# Nateria Japan Store Vol.61 MEREZ 61 (2) 63 ~ 130 (2022)



\* 三次元組織解析の最前線 \* 後編

実費 金属材料実験の手引き Ⅰ. 組織観察 調整 1-4 光学顕微鏡, SEM 観察のための試料の調整

- 新技術・新製品
- ・科学館めぐり 科学技術館(東京)

https://jim.or.jp/https://www.jim.or.jp/journal/m/ [オンラインジャーナル]日本金属学会会報 2022年2月1日発行 (毎月1回1日発行) Vol.61 No.2 ISSN 1340-2625

## **Advanced Imaging Tool** SU8600/SU8700

## HITACHI Inspire the Next

データの自動取得をサポート

・光学系の自動調整機能を搭載・ワークフローに応じた自動データ取得レシピを作成可能 ビッグデータ時代への対応・最大40,960 x 30,720 pixelまでの高解像度データを取得





SI NEWSは、弊社製品を使用した社内外の研究報文を中心に、先端の研究動向・ 技術情報をご紹介する技術機関誌です。Facebookページでは、本誌内容のご紹介を 中心に、皆さまのご研究に役立つ情報をタイムリーに発信してまいります。



Materia Japan

#### https://www.jim.or.jp/journal/m/

## 

2022 No.2

#### 特集「三次元組織解析の最前線後編」

|          | 企画にあたって 徳永透子 木口賢紀 大塚 誠 國枝知徳 篠原百合 高山直樹 塚田祐貴<br>山本剛久 山崎由勝                             |
|----------|---|
|          | 放射光を使った X 線 CT による 3D 観察 上杉健太朗 星野真人 竹内晃久 65   |
|          | 3次元アトムプローブ解析法の最近の進展<br>佐々木泰祐 埋橋 淳 大久保忠勝 宝野和博  |
|          | 中性子イメージングによる3次元可視化技術 篠原武尚   |
|          | TEM/STEM トモグラフィーによる最近の研究<br>波多 聰 趙 一方 井原史朗 斉藤 光 光原昌寿 村山光宏                           |
|          | EDS トモグラフィーによる三次元元素分布解析 青山佳敬  |
|          | 結晶学的な三次元組織解析を行うときの留意点 森戸茂一 林 泰輔   |
| 実学講座     | 金属材料実験の手引き<br>1. 組織観察 1-4 光学顕微鏡,SEM 観察のための試料の調整 高田尚記101                             |
| 新技術·新製品  | リマニュファクチャリングのための浸炭部品の損傷評価手法<br>金澤智尚 吉本光宏 ヴィニャス・ダン ベルトラン・ダニーロ 田原佑規 畑 典仁<br>菅原道雄 早川正夫 |
|          | 深紫外ピコ秒レーザーによる軟磁性材のアブレーション加工<br>河野健太 丸山裕樹 折井庸亮                                       |
| 科学館めぐり   | 科学技術館(東京都千代田区) 盛田元彰   |
| 美しい金属の写真 | Mater. Trans., 57(2016), 824–832; Figure 2114                                       |
| 本会記事     | 会告  |
| ム日の主任中古  | 次号予告  |
|          |   |

今月の表紙写具 如小試料の鉱物の3次元分布像 (上杉健太朗 星野真人 竹内晃久 著 66頁 図3より掲載)

表紙デザイン:ビーコン コミュニケーションズ株式会社 グラフィックスタジオ 複写をご希望の方へ 本会は、本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しております。本誌に掲載された著作物の複 写をご希望の方は、(一社)学術著作権協会より許諾を受けて下さい、但し、企業等法人による社内利用目的の複写については、 当該企業等法人が社団法人日本複写権センター((一社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体) と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては、その必要はありません。(社外頒布目的の複写については、許諾が必要です。) 権利委託先 一般社団法人学術著作権協会 〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル 3F FAX 03-3475-5619 E-mail: info@jaacc.jp http://www.jaacc.jp/ 複写以外の許諾(著作物の引用, 転載, 翻訳等)に関しては, 直接本会へご連絡下さい.

## 科研費関連機器・製品申請ガイド



〈材料検査・評価装置・製品〉

## 新素材研究用 自由共振式小試料 ヤング率及び内部摩擦測定装置 JEH-RT

#### 価格(税込): 330万円

ヤング率は材料の基礎的な物性値です。新素材研究に おいて、まず必須の測定項目ですが、研究初期においては 小さな材料しか作成できません。本装置はヤング率測定 において最も操作が容易で測定精度の高い自由共振式 装置で小試料測定を実現・開発したものです。試料は板 材、角材、線材など断面一様で長さ10mm程度、共振周 波数も100kHz程度までの試料の測定ができ、内部摩擦

測定もできますので、従 来の共振法装置より高 い周波数での測定も可 能となり、幅広い周波 数依存性(ひずみ速度 依存性)の測定も可能 となり、内部欠陥の研 究にも活用できます。



#### 日本テクノプラス株式会社

〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-5-21 第三丸善ビル TEL 06-6390-5993 URL: http://www.nihon-tp.com e-mail: info@nihon-tp.com

〈構造材料実験機器・製品〉



〈材料検査・評価機器〉

## MagnoMeter

価格(税込): 5,500,000円~ (アカデミックプライス、機種・仕様による)

分散体評価に最適化されたコンパクトなパルスNMRです。 高濃度分散体を希釈せずに評価可能です。 入力パラメーター無・ワンクリック・人為差なし・20秒で 結果が得られます。

高濃度微粒子分散体を希釈せずに評価する方法は多くは ありません。MagnoMeterは分散終点や粉体の濡れ性を

どなたでも簡単に数値化可 能です。高濃度微粒子分散 体から得られる結果は複雑 である場合もありますが弊 社所有の蓄積されたデータ およびノウハウによりそれ ぞれの分散体がどのような 状態であるか予測しフォ ローさせて頂きます。



#### マジェリカ・ジャパン株式会社代表取締役池田純子

〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-6 東葛テクノプラザ 609 TEL 04-7189-8158 info@mageleka-japan.com https://www.mageleka-japan.com/index.html



## 科研費関連機器・製品申請ガイド

#### 〈ソフトウェア・書籍・サービス〉 〈ソフトウェア・書籍・サービス〉 化学反応/平衡計算ソフトウエア 約30,000件のセラミックス状態図データベース HSC Chemistry for ACerS-NIST Windows, Ver. 10 Phase Equilibia Diagrams, Version 4.5 定価(税込)¥220,000 約28.000種についてのエンタルピー、エントロピー、熱容量のデー (シングルユーザー) タベースを基に化学反応の計算やGIBBSルーチンによる化学平衡 を計算します。反応、熱平衡、分子量計算などの一般的なモジュー ルの他、電気化学セル平衡と相安定性、腐食の研究に使われる Eh-pH (プールベ) 状態図の作成などユニークなモジュールを持ち 合わせています。計算結果のテーブルと状態図はクリップボードにコ ピーできます。SIM Flowsheetモジュールもあり、複数のユニットプ ロセスからなるプロセス全体のシミュレーションとモデリングがで きます。Ver.9.4から3元状態図作成のツールが付いています。 ●データソース: Phase Equilibrium Diagrams for Ceramics、Vol. 1 年間使用料(税込) (対応書籍) XIV, Annual 91-93, High-Tc Superconductors I - II, ¥319.000(一般) Zirconium and Zirconia System, Electric Ceramics I ¥110,000(教育) :元素、成分系、コメントテキスト、PED Volume、Figure ●検索項目 Number、刊行年、Authors ●検索条件 : Inclusive、Exact、Not (partially) システムプラットフォーム: ●データ出力 : PDF、PNG (Portable Network Graphics) Windows 8/10 ●システム構成: Windows 8/10、 Java 7 Runtime Environment、 PDF (Outototec Research Reader (Javaはサムネイル画像の拡大に必要) Oy. 製作) (American Ceramic Society) 株式会社 ディジタルデータマネジメント 株式会社 ディジタルデータマネジメント 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-11-8 紅萌ビル 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-11-8 紅萌ビル TEL 03-5641-1771 FAX 03-5641-1772 TEL 03-5641-1771 FAX 03-5641-1772 http://www.ddmcorp.com http://www.ddmcorp.com 日本金属学会発行誌



前付)1色1P ¥100,000(税別) 1/2P ¥60,000(税別) 後付)1色1P ¥95,000(税別) 1/2P ¥55,000(税別) ※表紙回り、カラー料金等お問い合わせ下さい。

広告のご

## 春・秋期講演大会プログラム

後付)1色1P ¥70,000 (税別) 1/2P ¥40,000 (税別)

広告ご掲載についてのお問い合わせ・お申込み

株式会社 明 報 社

〒104-0061 東京都中央区銀座7-12-4 友野本社ビル TEL(03)3546-1337 FAX(03)3546-6306 E-mail info@meihosha.co.jp HP www.meihosha.co.jp



## FRITSCH "NANO 領域"





#### 特色

- 1. 従来弊社 P-7と比べて 250%の粉砕エネルギー UP。 自転公転比:1:-2. Max 1,100/2200rpm 粉砕エネルギー: Max 94G (現状 P-7: 46.08G)
- 2. 容器は本体内に。 外部に飛び出す危険は無し。
- 3. 搭載容器も20、45、80mlの3種類。 材質は従来どおり多様。 雰囲気制御容器も各種用意。



## 従来型ボールミル "CLASSIC LINE"

premium lineと並んで従来どおりの 遊星型ボールミルトリオも合わせて ご提供いたします。







フリッチュ社が開発した 遊星型シリーズの パイオニア機種。



世界で初めて容器ひとつで 遊星運動に成功した ペストセラー機種

P6

少量試料を対象にした パワフルな機種

全機種共通の特長

●雰囲気制御容器以外の 通常容器、ボールの材質 は、ステンレス、クローム、 タングステンカーバイド、メ ノー、アルミナ、ジルコニア、 窒化ケイ素、プラスチック ポリアミドの8種類。

- ●乾式、湿式の両粉砕も可能。
- ●ISO9001、CE、TÜVの国際基準をクリア

カタログおよび価格表は弊社にお問い合わせください

## フリッチュジャパン株式会社

社 〒231-0023 横浜市中区山下町252 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-2-7 URL http://www.fritsch.co.jp E-mail info@fritsch.co.jp

P7

TEL 045-641-8550 FAX 045-641-8364 TEL 06-6390-0520

FAX 06-6390-0521



|   | 創業1   | 921  | 年   |   | 2  | 021.10改  |
|---|---|--|---|---|--|--|
| ALLO  | <b>YS 8</b>   |  |   |   | <b>S</b>   |  |
| 品名  | 品名  | 純度   | 形状  | 品名  | 純度   | 形状   |
| 純金属   | 高純度   | き 金 属  |   | 中間  | 合金   |  |
| 高純度アルミニウム99.99% $約1kg1/ンゴット$ アルミニウム粒>99.7%地状 1kg入アルミニウム粉99.99%地状 1kg入アルミニウム粉99.99%松水 1kg入アルミニウム粉99.99%松水ポロンクリスタル99.4%3~8mm/小塊ボロンアモルファス95~97%粉ビスマス99.99%針状ゴバルト粒(ロシア産)99.9%封電解コバルト(従来品)99.9%ガ電解コバルト(従来品)99.9%カレーク状電解コバルト(ドB)99.9%物55×25×10mm金属クロム99%携ポ<   | アア銀ビスス マスス<br>ビビ高無鉄ガゲイイマ3<br>ビビ高無鉄ガゲイイマ3<br>酸イロ ウ ウ ウ ム<br>レママジジ ガ シン<br>リマジジ ガ モモモルル<br>ルルンンン シ チチルルル<br>の<br>のウ ウ ウ ウ ムムン<br>シンンルル<br>レルンンフ<br>シンンル<br>レアアー<br>イニット | 99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999%<br>99.999% | 粒約粒粒約薄100g<br>地約粒粒約薄100g<br>状100g<br>状100g<br>状100g<br>状100g<br>状100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大100g<br>大<br>大100g<br>大<br>大100g<br>大<br>大100g<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大<br>大 | 燐シママクテコニ鉄チジボ ア アアアアア アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア   | $\begin{array}{ccccccc} P>14.5\% \\ Si & 15\% \\ Mn & 25\% \\ Mg & 50\% \\ Cr & 10\% \\ Te & 50\% \\ Co & 10\% \\ Ni & 30\% \\ Fe & 10\% \\ Ti & 50\% \\ Zr & 50\% \\ B & 2\% \\ Cu & 40\% \\ Mg & 20\% \\ Mn & 10\% \\ Ni & 20\% \\ Cr & 5\% \\ Ti & 5\% \\ Si & 25\% \\ Co & 5\% \\ Mo & 5\% \\ W & 2.5\% \\ Be & 2.5\% \\ Fe & 50\% \\ Zr & 5\% \\ Be & 4\% \\ Fe & 50\% \\ Zr & 5\% \\ Be & 4\% \\ Fe & 50\% \\ Zr & 5\% \\ B & 4\% \\ Fe & 50\% \\ Zr & 5\% \\ B & 4\% \\ Fe & 50\% \\ Cr & 5\% \\ Co & 5\% \\ Fe & 50\% \\ Zr & 5\% \\ Cr & 5\% \\ Si & 25\% \\ Cr & 5\% \\ Cr & 5\% \\ Si & 25\% \\ Cr & 5\% \\ $ | 粒<br>約1kg インゴット<br>約800g インゴット<br>約約1kg インゴット<br>シ<br>シ<br>シ<br>シ<br>シ<br>シ<br>ン<br>フ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ット<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ッ<br>・<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>ブ<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>ン<br>ブ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>、<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>ン<br>ゴ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>、<br>ン<br>ー<br>ジ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>、<br>ジ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>、<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>・<br>シ<br>ン<br>・<br>ン<br>ジ<br>・<br>ジ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>、<br>シ<br>ン<br>、<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>・<br>シ<br>ト<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>・<br>シ<br>ン<br>・<br>ン<br>ジ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ト<br>ン<br>ジ<br>ッ<br>・<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>・<br>シ<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>ッ<br>・<br>シ<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>・<br>シ<br>ト<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>シ<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>シ<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ン<br>ジ<br>・<br>ン<br>ン<br>ン<br>シ<br>ン<br>ジ<br>ン<br>ン<br>シ<br>ン<br>ン<br>ジ<br>ン<br>シ<br>ン<br>ン<br>ン<br>シ<br>ン<br>シ |
| 電気ニッケル       99.99%       25×25×10mm         ニッケルペレット       99.97%       6~12mm球状         レニウム粉       99.99%       粉末         ルテニウム粉       99.99%       ポ         アンチモン       99.9%       ポ         金属シリコン(ブラジル産)       99%       *         場インゴット       99.99%       *         タンタル塊       99.9%       *         タンタル粉       99.9%       *         ア       シータル       *         タンタル粉       *       *         ア       シータル       *         タンタル粉       *       *         ア       ジースポンジ塊       *         ア       シータン       99.7%         スポンジ塊       *       *         シンタン       *       *         シック       *       *         *       *       *         *       *       *         *       *       *         *       *       *         *       *       *         *       *       *         *       *       *         *       *       *         *       *       * | ラブネサイテジホエガツルセユシセ オ ジ ウ ウ ウ オ リ ルビ ウ ウ カ ムム レルド リ テ リ ロビウ ウ ウ カ ムムムムムムムムムムムムムムムムムムム  |  | <i>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * </i>   | アルミバナジウム<br>アルミストロンチウム<br>アルミカルシウム<br>ニッケルボロン<br>ニッケルニオブ<br>ニッケルマグネシウム<br>コバルトボロン<br>燐 錫<br><b>Uアロイ</b><br>U ア ロ イ 47   | V 50%<br>Sr 10%<br>Ca 10%<br>B 15%<br>Mg 50%<br>B 15%<br>P 5%<br>P 5%<br><b>(低融点</b> 在<br>融点47±2℃  | 3~10mm/塊状<br>約100gインゴット<br>約2.5kgインゴット<br>1~30mm/塊状<br>塊 状<br>塊 状<br>インゴット<br>インゴット  |
| バ ナ ジ ウ ム 粉 / 粉 末<br>タン グ ス テ ン 粉 99.9% /<br>タングステンスクラップ 99% 板 状<br>亜 鉛 イ ン ゴ ッ ト 99.99% 約2㎏インゴット   | ミッシュメタル<br>フェロ  | TRE>97%<br>アロイ   | 5.4¢×6mm<br>200g入   | U       7'       I       1       60         U       7'       I       1       70         U       7'       I       1       78.8         U       7'       I       1       91.5 | 60±2°C<br>70±2°C<br>78.8±2°C<br>91.5±2°C   | "<br>"<br>"  |
| 亜 鉛 粒   | フェロモリブデン<br>フェロニオブ<br>フェロバナジウム<br>フェロボロン<br>カルシウムシリコン<br>フェロホスホル(リン鉄)   | Mo 60%<br>Nb 60%<br>V 80%<br>B 20%<br>Ca30%Si60%<br>P20~28%  | 3~10mm小塊状<br>10~30mm 〃<br>3~15mm 〃<br>1~30mm 〃<br>小 塊 状<br>塊 状  | U 7 1 7 95<br>U 7 1 7 100<br>U 7 1 7 124<br>U 7 1 7 150A  | 95±2℃<br>100±2℃<br>124±2℃<br>150±2℃  | 4<br>14<br>14<br>14  |

創業1921年





本社·昭島製作所 〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2 TEL:(042)543-1111(大代表) FAX:(042)546-3353 www.jeol.co.jp ISO 9001·ISO 14001 認証取得

JEOLグループは、「理科学・計測機器」「産業機器」「医用機器」の3つの事業ドメインにより事業を行っております。 「理科学・計測機器事業」 電子光学機器・分析機器・計測検査機器 「産業機器事業」 半導体関連機器・産業機器 「医用機器事業」 医用機器

| 高精細X線  | 高速検出器   |            | 材料特性のその場観察                                    |
|--|---|------------|---|
|  |   |            | ~表面形態•結晶方位•機械特性~                              |
| Fiber-optic sCMC   | )S  |            |   |
| Zyla5.5 HF   |   |            | 加熱フテージ  |
| A SULLAR N   | Z/AMDOR   |            |   |
| INSTRUMENTS ANDOR  |   |            | FurnaSEM1000                                  |
| 主なアプリケーション   |   |            | • 1000°Cまで                                    |
| ● X線・中性子トモグラ   | ラフィ ● X 線撮像   | 1          | <ul> <li>EBSD 観察可</li> <li>ガス注入キット</li> </ul> |
| ● 電子顕微鏡(TEM)   | 撮像 ● X 線回折  | ナ          | • Y7F9TF &K                                   |
| モデル  | ADS-343 (Zyla HF)   |            | NewTec  |
| センサータイプ  | sCMOS FOP 付き  |            | Scientific                                    |
| イが回来数  | 6.5 μm (3μm/13μm)   |            |   |
| 最大量子効率   | 60 %  |            | 引張ステージ・機械特性                                   |
| ダイナミックレンジ  | 33,000:1  |            |   |
| フレームレート  | 最大 100 fps  |            | <u>MT1000</u>                                 |
|  |   |            | • 引張、圧縮、屈曲                                    |
|  |   |            | ● 温度勾配付加熱                                     |
|  |   |            | • ガス注入キット                                     |
| マインロ/  | 、称リスフ   |            | • 99F919 88                                   |
|  |   | 12         | NewTec  |
| 1.7.7.4  | ×4.15   |            | Scientific                                    |
| V X X Y J J Z J  | ルメフ   |            |   |
| Kenvy2   |   |            | <u> </u>                                      |
| 5  |   |            |   |
|  |   | H          |   |
|  |   | 1          |   |
|  |   | HIT        | 400°C   |
|  |   | 山口         |   |
| <ul> <li>シンチレータ、リレー</li> <li>ラによる、高い変換効素</li> </ul>  | レンスシステム,sCMOS カメ<br>率を持つ間接変換方式の X 線   |            | 白金の粒成長 EBSD観察                                 |
| カメラシステム  |   |            | 23°C 410°C 500°C 600°C                        |
| ● 放射光による X 線マイ?  | クロ CT に最適   |            | Grain grwoth                                  |
| <ul> <li></li></ul>  | フォーカス調整   |            | 700°C 717°C 717°C 717°C                       |
| ● 標準蛍光体 (Csl) のは<br>選択可能な蛍光体 (GA   | か<br>GG.LuAG.YAG)   |            | Re-crystallization Room T                     |
|  |   |            | Recrystalized grains                          |
| モデル  | ADS-347 (Kenvy-2)   |            | 変形試験  |
| センサータイプ  | sCMOS   |            |   |
| 日外回系数  | 6 5 um  |            | 480°C   |
| 最大量子効率   | 82 %  |            |   |
| ダイナミックレンジ  | 33,000:1  |            |   |
| フレームレート  | 最大 53 fps   |            |   |
| 参考文献:Yoneyama, A., Baba, R. & Kawamoto, M. ,Quan<br>CWO, YAG, BGO, and GOS scintillators using 10-, 20- and 34<br>Express 11, 3989-411 (2021). | ntitative analysis of the physical properties of CsI, GAGG, LuAG,<br>4-keV monochromated synchrotron radiation, Optical Materials |            | 550°C   |
|  |   | -          | *詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。                            |
| お問い合わせはこちら   | https://www.  | ads-img.co | o.jp/   |
|  |   |            | 〒273-0005 千笹県松埼古大町2-2-2016大町プニ+ポビリ            |
| A別ろ 株式   | 会社ノド・サイ」  | _ノ人        | Tel: 047-434-2090 Fax: 047-434-2097           |

## CMOS 搭載 超高速 EBSD 検出器

EBSD に最適化した CMOS イメージセンサーを搭載し、 高速・高感度分析を実現

- 最大毎秒 >4500ポイントの高速分析
- 全ての分析で高感度・高スループットを実現
  - » 最高速分析時でも高いパターン解像度でデータ収集
  - » 最大 1244 × 1024の高解像度パターンを取得可能
  - » 複雑な酸化物や薄膜など、分析が難しい試料に対応した高感度性能
  - » 高い角度分解能 0.05°
- 洗練された機構設計
  - » 検出器チルト機構搭載(モーター駆動自動キャリブレーション)
  - » 非接触衝突センサー内蔵





Ni 試料から収集した 高解像度 EBSP (1244x1024)

曲げ加工した Ni シート試料の結晶方位マップ 毎秒 4600 ポイントで分析 収集時間 約 2 分

オックスフォード・インストゥルメンツのホームページ (nano.oxinst.jp) では、 EDS や WDS、EBSD 分析について、皆様の分析業務にお役に立てる情報を発信しています。

- 様々な分野での分析事例をご紹介するアプリケーションノートのダウンロード
- 分析技術をご紹介する各種ウェビナー
- 分析ソフトウェアの使用方法をご説明するチュートリアルビデオ(英語)
- 分析のヒントなどを毎週発信するブログ

#### オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

#### 分析機器事業部

www.oxinst.jp

〒140-0002 東京都品川区東品川 3-32-42 IS ビル TEL: 03-6732-8967 / FAX: 03-6732-8939 e-mail: na-mail.jp@oxinst.com









#### 三次元組織解析の最前線 後編

企画にあたって

徳永透子<sup>1</sup>
 木口賢紀<sup>2</sup>
 大塚 誠<sup>3</sup>
 國枝知徳<sup>4</sup>
 篠原百合<sup>5</sup>
 高山直樹<sup>6</sup>
 塚田祐貴<sup>7</sup>
 山本剛久<sup>7</sup>
 山崎由勝<sup>8</sup>

近年、分析機器の性能向上は目覚ましく、従来不可能であ ったスケールでの観察や解析が様々な分野で可能となりつつ ある. その結果,装置ありきで新しい研究領域や研究テーマ が開拓されていく場面も多く見受けられるようになった. ま た、古くから知られている手法が自動化・デジタル化される ことで改めて見直され、新たな脚光を浴びる例もある.一方 で、このような装置開発の加速により、装置のポテンシャル を最大限に引き出し、データを正しく解釈するために、研究 者や技術者は最先端の知識を絶えず取り入れつづけることが 求められている.本特集記事では,前号に引き続き「三次元 組織解析の最前線」として、最先端の組織解析手法に加え て、既に活用されてきたものの今後さらなる発展が期待され る解析手法に着目した. また, 最新の組織解析手法を紹介し つつ、初学者や材料開発の現場の研究者にも広く興味を持っ ていただける記事となることを目指し、ご執筆者には各手法 の要点や基礎的な説明もあわせてご執筆いただいた.

本特集は6分野との連携企画であり,6分野が担当した前 号の特集記事「三次元組織解析の最前線 前編」では種々の 組織解析手法の原理・撮影・解析技術を中心とした解説をい ただき,本特集(後編)では,金属材料・材料組織の三次元解 析の応用例を中心に紹介させていただいた.

まずは, SPring-8 にて X 線 CT 装置と X 線画像検出器の 開発にご尽力されている上杉健太朗氏(JASRI)に「**放射光を 使った X 線 CT による 3D 観察**」と題して, 放射光 X 線 CT 技術を用いた最新の応用例を, SPring-8 における最近の動

向を中心に解説をいただいた.3次元アトムプローブ (3DAP)を用いた多くの実用金属材料の組織解析に携わる 佐々木泰祐氏(NIMS)には「3次元アトムプローブ解析法の 最近の進展」と題して、3DAPにおける試料作製手法から TEM との相補的活用による組織解析,最新の応用事例など についてご紹介いただいた. また, 中性子を利用した実験技 術を幅広く開発・応用されている篠原武尚氏(JAEA)には 「中性子イメージングによる3次元可視化技術」と題して, 材料中のひずみや結晶粒サイズの分布の可視化をはじめとす る、中性子イメージング技術の材料分野への応用例をご紹介 いただいた. TEM および STEM による転位など材料組織 の三次元観察を実施されている波多聰教授(九州大学)には 「TEM/STEM トモグラフィーによる最近の研究」と題し て、電子線トモグラフィー技術を駆使したその場観察につい て,最近の研究をご紹介いただいた.また,電子線を用いた 高精度な三次元観察に注力されている青山佳敬氏(日本電子) に「EDSトモグラフィーによる三次元元素分布解析」と題 して EDS トモグラフィーの基礎から、高精度な観察を行う ための技術開発,応用例についてご説明いただいた.最後 に,電子顕微鏡を用いた組織解析手法の開発にご尽力されて きた森戸茂一教授(島根大学)に「結晶学的な三次元組織解析 を行うときの留意点」と題して、精確なデータを得るために 必須である,三次元像解析の際の留意点を詳細にご解説いた だいた.

なお、前編ですでに紹介された手法に関しては、基礎的な

| 1 名古屋工業大学大学院工学研究科(〒466-8555 | 名古屋市昭和区御器所町) |
|-----------------------------|--------------|
|-----------------------------|--------------|

2 熊本大学先進マグネシウム国際研究センター

6 JFE スチール株式会社スチール研究所

<sup>3</sup> 東北大学多元物質科学研究所

<sup>4</sup> 日本製鉄株式会社鉄鋼研究所

<sup>5</sup> 東京工業大学科学技術創成研究院

<sup>7</sup> 名古屋大学大学院工学研究科

<sup>8</sup> 宇部工業高等専門学校機械工学科

Preface to Special Issue on "New Trends of 3D Imaging and Analysis (3D Observation, Reconstruction and Analysis)"; Toko Tokunaga<sup>1</sup>, Takanori Kiguchi<sup>2</sup>, Makoto Ohtsuka<sup>3</sup>, Tomonori Kunieda<sup>4</sup>, Yuri Shinohara<sup>5</sup>, Naoki Takayama<sup>6</sup>, Yuhki Tsukada<sup>7</sup>, Takahisa Yamamoto<sup>7</sup>, Yoshikatsu Yamazaki<sup>8</sup>

Keywords: three-dimensional observation, tomography, X-ray, neutron imaging, energy dispersive X-ray spectroscopy, three-dimensional atom probe

<sup>2022</sup>年1月4日受理[doi:10.2320/materia.61.63]

説明は省いてご紹介いただいた.予めご了承いただくととも に,あわせて前編をご覧いただきたい.また,前編と同様, 本誌ではグレースケール印刷となっている. 理解が難しい図 に関しては、カラーで掲載されているオンライン版(https:// www.jim.or.jp/journal/m/61/02/)をあわせてご覧いただき たい.本特集記事が,三次元解析技術と材料研究が相互に発 展する一助となれば幸甚である.

末筆ながら、本特集を企画するにあたり、ご多忙にもかか わらずご執筆いただいた著者の先生方に心より御礼申し上げ ます.また,分野間での連携企画という試みにおいて,著者 への依頼,構成,編集等について田辺栄司様(広島県立総合 技術研究所), 佐々木秀顕先生(愛媛大学)をはじめとする6 分野の先生方には多大なるご協力をいただきました. この場 を借りて厚く御礼申し上げます.





木口賢紀



大塚 誠







高山直樹



塚田祐貴



篠原百合





三次元組織解析の最前線 後編

## 放射光を使った X線 CT による 3D 観察

上杉健太朗 $_{1}^{*}$  星 野 真 人 $_{2}^{*}$  竹 内 晃 人 $_{2}^{*}$ 

#### 1. はじめに

X線CT法は被写体の内部構造を可視化する手法であり, Hounsfieldによる医療診断用X線CTスキャナーの開発<sup>(1)</sup> から医療診断分野を中心として広く使われている.X線CT 法の特長は内部の三次元情報すなわちX線吸収係数の分布 を非破壊かつ定量的に計測出来ることである.

材料科学などの分野における要求として高空間分解能 X 線 CT 撮影があり、2000年ごろからラボ用装置も放射光 X 線を利用した装置も急激に高空間分解能化が進んだ. 2000 年ごろはせいぜい 3-5 µm 程度だった空間分解能は、本稿執 筆時点ではラボ用装置<sup>(2)-(4)</sup>も1µm以下の空間分解能に到 達しているし、放射光施設特有のX線顕微鏡光学系を利用 した装置では 100 nm 以下という値も珍しくない<sup>(5)-(7)</sup>.X 線 CT 装置の開発自体,国内はもちろん世界中の放射光施設 において行なわれている<sup>(8)(9)</sup>. それぞれの施設あるいは担当 者の特徴を活かした装置が稼働しており、生物・材料等様々 な研究分野での利用が進んでいる.X線CT計測において放 射光X線を使う理由は、その圧倒的な単色性と光束密度を 生かし,空間・時間・密度(コントラスト)の各分解能を上げ ていくことである. また, CT 計測の可能性を拡げるという 意味では、高エネルギーX線の利用は欠かせなくなってき ている. 例えば単純な投影型では X 線光学系の改良や画像 検出器の改良が進み, ESRF や SPring-8 を中心に 100 keV 以上での計測の重要性が認知されてきている.

本稿では大型放射光施設 SPring-8 における,X線 CT 計測の最近の進展とこれからの課題について述べる.

#### 2. 最近の進展

 X 線顕微鏡光学系を利用した X 線ナノ CT・マルチス ケール CT

#### (a) X 線ナノ CT

顕微的目的で用いられる X 線 CT は,およそ 1 µm の空間 分解能を境界に2つに大別される.投影光学系をベースと した X 線マイクロ CT (図 1)は約 1 µm 以上の構造を捉える ことができ,それより細かい構造を観察するためには X 線 顕微鏡技術と組み合わせた X 線ナノ CT が用いられる.メ ゾスコピックとよばれるナノ〜ミクロンの構造領域は,電顕 と光顕がカバーする領域の間にあることから多くの分野(材



図1 放射光 X線マイクロ CT 装置の模式図. (オンラインカラー)

\* 公益財団法人高輝度光科学研究センター;1)主席研究員 2)主幹研究員(〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1) 3-D Observation with Synchrotron Radiation X-ray CT.; Kentaro Uesugi\*, Masato Hoshino and Akihisa Takeuchi(\*Japan Synchrotron Radiation Research Institute, Sayo-gun, Hyogo) Keywords: *synchrotron radiation, x-ray, micro-tomography* 2021年10月13日受理[doi:10.2320/materia.61.65] 料科学,地球惑星科学,電池・デバイス)において未知の領域となっている.X線ナノCTはこの領域の3次元構造を非破壊で観察することができる装置として期待されている.現状の3次元構造計測の実用レベルの空間分解能は100 nm 前後であるが<sup>(10)(11)</sup>,これが数十 nm に達すればこの領域は完全にカバーできる.

X線ナノCTのベースとして用いられるX線顕微鏡は、 様々な技術が提案・開発されてきた.集光ビームを走査プロ ーブとして用いる走査型X線顕微鏡や、X線用の対物素子 を像拡大用の結像素子として用いる結像型X線顕微鏡,さ らに高コヒーレンス光を利用したホログラフィや coherent diffraction imaging (CDI),あるいはその技術を応用した ptychography が急速に発展してきた.これらは、それぞれ 特徴を持つが、中でも結像型X線顕微鏡は単位時間辺り得 られるデータ量が最も大きく、光源に要求される性能も他と 比べて少ないことから、放射光だけでなく実験室系において も利用されている.特に大強度X線が利用できる放射光施 設においては様々な状況下での測定やその場観察等の利用も 広がっている.

ここでは、SPring-8 BL20XU, BL37XU, BL47XU で共用 利用されている結像型 X 線顕微鏡をベースとした X 線ナノ CT を紹介する. 概略図を図2に示す. 光学系は基本的に光 学顕微鏡のそれと同じである. コンデンサにより試料面上直 径 50~100 µm 程度の領域を均一に集光照射し, 試料を透過 した X線は X線対物素子で拡大され,X線画像検出器の検 出面上で結像される.ただし,X線の屈折率はあらゆる物 質に対してほとんど1であるため,可視光領域で用いられ るレンズのような屈折型、反射型の素子は、そのままでは X線領域では対物素子として有効に機能しない.X線領域 に特化した様々なX線光学素子が開発されているが,ここ では、フレネルゾーンプレート(Fresnel zone plate, FZP, NTT Advance Technology)と呼ばれる, X線の回折を利用 するタイプの素子を対物素子として用いている.検出器に は、レンズカップル式可視光変換モジュールを取り付けた 16bit sCMOS(ORCA Flash 4.0, 浜松ホトニクス)カメラを 利用しており、測定時の実効画素サイズは 30~50 nm 程度 である.ナノオーダーのCT計測を可能とするために,試料 の回転ステージにはスライドガイド軸受け式回転ステージ (神津精機)を用いており、軸ブレ精度は100 nm 程度であ る. 光学素子製作の技術的困難さから, エネルギー領域は



 図2
 X線顕微鏡光学系を利用したX線ナノCT装置の模式

 図.(オンラインカラー)

10 keV 程度あるいはそれ以下での利用に長年限られてきた が,近年数十 keV の高エネルギー利用も可能になってき た<sup>(11)(12)</sup>.

X線の回折を利用する FZP の場合,X線のエネルギーに よって焦点距離が変わるため,結像顕微鏡光学系として必要 な鏡筒長もエネルギーによって異なる. 鏡筒長7mの BL47XU, 27mのBL37XUは主に6~15keVのエネルギ ー領域で, 鏡筒長 165 m に達する BL20XU では 15~37.7 keV のエネルギー領域に対応する.これらの装置の空間分 解能は実測で 50-100 nm (half-pitch)である<sup>(10)(11)</sup>. また, 通常の吸収コントラストに加え, ゼルニケ型位相コントラス ト法による高感度計測も可能である. 一般的な CT 測定時間 は、BL47XUでは7.5分(露光 0.25 s/frame, 1800投影), BL20XU では15分~30分(0.5~1 s/frame×1800投影)であ るが、露光時間や投影数を減らすことで高速計測も可能であ る. 測定例として、小惑星探査機はやぶさが持ち帰った、小 惑星イトカワの微粒子の CT 像を図3 に示す.鉄の吸収端を 挟む7keVと8keV2つのX線エネルギーで吸収係数の定 量測定をすることによって、鉱物の3次元分布の精細なマ ッピングに成功している. この CT データから, イトカワは 地球上で見つかる LL4-6 普通コンドライトと呼ばれる隕石 と同じような鉱物組成を持っているということが示され  $c^{(13)}$ .

#### (b) マルチスケール CT

「できるだけ試料をこわさず,できるだけ大きいものを, できるだけ高い解像度で観察したい」というのは,普遍的か つ究極の目標の一つといえよう.分解能と視野を段階的に切 り替えるマルチスケールイメージングはこの要求に答える測 定技術の一つといえる.光学顕微鏡では対物レンズを交換す るなど,マルチスケールイメージングは確立された技術とし て容易に利用されている.しかし,物体内部を観察する 3D イメージングでは,このような測定を非破壊で行うことは容 易ではない.なぜなら,対象物は視野に対して平面的に大き いだけではなく,光軸方向にも大きな厚みを持つからであ る.このような状況では,プローブ光には,大きな物体を透 過させるための高い透過力と,微細構造による微小なコント ラスト変動を検出するための物質との高い相互作用という,



図3 小惑星探査機はやぶさによりもたらされた小惑星イトカ ワの微小試料の鉱物の3次元分布像.(オンラインカラー)

相反する特性が求められる.この要求に応えるために,X 線マイクロCTと高エネルギーX線位相差ナノCTを組み 合わせたX線マルチスケールCTシステムが開発され た<sup>(11)(12)</sup>. これは前述したように,近年 20 keV 以上の高エ ネルギーX線に対応可能になったことで実現した技術であ る. 高い透過力を持つ高エネルギーX線を使えるようにな ればより多くの物質を破壊せずにそのメゾスコピック領域の 「生きた」構造観察,つまり3次元でなく4次元あるいはそ れ以上の観察が可能になり、材料の真の理解につながる. SPring-8ではBL20XU, BL47XUでこのマルチスケール CT が実施されている.実験装置は、広視野・低解像度イメ ージング用のマイクロ CT(図1)と、狭視野・高解像度イメ ージング用のナノCT(図2)の組み合わせで構成されてい る. マイクロ CT で試料全体を撮影し, 試料をステージから 取り外すことなくナノCT でその関心領域(region of interest, ROI)を精密に計測する. 両者の測定モードは, 専用 ソフトウエア上で簡単に切り替えることができる.ナノCT モードでは巨大な試料の微細構造を感度良く計測するために, X線位相コントラスト法による高感度計測が導入されてい る.本システムは、大きな物体の内部をナノメートルスケー ルで非破壊的に 3D イメージングできるという利点に加え, マイクロ CT 計測を組み合わせることでミリサイズの試料を 扱えることから、試験機も導入しやすく、時分割、in-situ、 ex-situ, operando などの 4D-CT 観察がより容易に実施で きるようになった.

測定例として、チタン合金 Ti-6Al-4V の内部起点の疲労 き裂を非破壊で観察した例を図4に示す.チタン合金は、そ の優れた機械的特性から航空機材料等にも広く使われている が、107 回を超える非常に高いサイクルの負荷がかかると内 部疲労破壊を起こすという問題があり、この亀裂の発生と成 長のメカニズムの理解が急務となっている<sup>(14)</sup>.実験ではま ず、直径 0.45 mm の試料(図4(a))の全体をマイクロ CT モ ードで測定した(図4(b)).次に、マイクロ CT データから 内部亀裂の位置を特定した(図4(b)の丸で囲んだ部分).最 後に、特定した内部領域をナノ CT モードで非破壊的に観察 した(図4(c)). ( $\alpha$ + $\beta$ )二相微細構造と初期クラックの3次 元的な位置関係が明確に観察できる.また、試験機で追加の 負荷をかけることによって、内部亀裂の伝播過程の精細な追 跡も可能となった(図4(d)).

#### (2) 高エネルギー計測と高精細化

大型の試料、あるいは適当なサイズであっても高密度物質 で構成される試料の内部構造を非破壊で可視化しようとした 場合,その試料に対して十分なX線透過率を得るために は、高エネルギー領域のX線が必要となるということは周 知の通りである.なお、本項での高エネルギー領域とは、概 ね100 keV 以上を差すこととする. そのため, 高エネルギ ーX線マイクロCTでは、鉄や銅といった標準的な金属材 料から構成された試料や化石試料などが主なターゲットとし て挙げられる. 高エネルギーX線という点に限定すれば, 産業用・工業用 CT 装置など,放射光施設で利用可能な X 線エネルギーよりもはるかに高いエネルギーによる測定も可 能であるが(15)、ミクロンオーダーの空間分解能における計 測,あるいはX線ビームの空間コヒーレンスを活かした屈 折コントラストを用いた高コントラスト測定などは、放射光 ベースの高エネルギーX線画像計測が得意とするところと いえる.一方で,X線エネルギーに依らず,試料内部構造 を包括的かつ詳細に観察したいというニーズは昔からあり、 "高精細画像計測"という計測技術の成熟を待つ必要があっ た.近年科学計測における高精細 CMOS カメラの実用化に より,X線画像計測の高精細化を本格的に進める時期に来 ていると考えられる.本稿で取り上げる高エネルギーX線 マイクロCTの場合,幸いなことに,測定ターゲットは上記 のように大型化する傾向があるため、高精細画像計測を組み 合わせることで、内部構造を広く・細かく可視化する技術と して相性が良い. ここでは, SPring-8 における高エネルギ ーX線マイクロCTの最近のアップデートと、それに高精 細カメラを組み合わせた測定の現状について紹介する.

まず,放射光施設における高エネルギーX線ビームの効率的利用に関して述べる.画像計測に限らず,放射光X線を用いた計測の場合,一般的には分光器で単色化されたX線が用いられる.特に,ある元素の吸収端近傍における測定や,フレネルゾーンプレートといった回折型の光学素子を用いた測定の場合,分光器を通して得られる単色性の高いX線の有用性は言うまでもない.その一方で,高エネルギー領域のX線画像計測では,必ずしも高い単色性が必要となるわけではなく,むしろ積分強度が重要視される画像計測においては,エネルギー分解能に優れた分光器から得られる単色





X線では、必要以上に単色性が上がり、かえって非効率的 となる. また, SPring-8のような大型放射光施設といえ ど,高エネルギー領域のX線強度は低下していくため,効 率の良い高エネルギーX線画像計測のためには、エネルギ ーバンド幅の広い X線ビームの利用が適切といえる.そこ で、最近の高エネルギー X線画像計測では、放射光偏向電 磁石光源から得られる白色X線に着目して、その高エネル ギー領域成分を広いエネルギーバンド幅で利用する計測技術 開発の推進している.分光器を使わずに,高エネルギー領域 のX線を取り出すには,適当な材質・厚みのアブソーバー を用いて、低エネルギー成分を除去する方法が最も簡便であ る. ここでは, 適当なアブソーバーを用いて, 高エネルギー X線を取り出す方法を紹介する.SPring-8の偏向電磁石か ら得られる白色X線に対して、タングステン厚さ0.5mm と鉛厚さ2mm を組み合わせたアブソーバーを用いることに より, ピークエネルギー約200 keV, エネルギーバンド幅 100 keV 程度の高エネルギー白色 X 線スペクトルを得るこ とができる<sup>(16)</sup>.アブソーバー自身には、白色X線照射によ り強い熱負荷がかかるため、空冷をするとともに、光源側に タングステンを配置することにより、鉛への熱負荷を軽減 し、その変性を防いでいる.また、アブソーバー自身の透過 強度ムラに伴う、透過投影像および CT 再構成像への影響を 低減させるために,X線ビームに直交する面内でアブソー バーを 1500~2000 rpm で回転させている.

SPring-8 では,偏向電磁石ビームライン BL28B2 におい て,白色 X 線を用いた高エネルギー X 線マイクロ CT を行 うことが可能である.測定光学系の概要を図5に示す. BL28B2 は,計測に利用できるハッチが2つあり,光源に近 い上流側の光学ハッチ2に試料ステージを設置し,下流側 の光学ハッチ3に X 線画像検出器を設置している.なお,

高エネルギー領域のX線を取り出すためのアブソーバーお よび高エネルギーX線用シャッターは光学ハッチ1の最下 流部分に設置している. 高エネルギーX線用シャッター は、ロータリーソレノイドにより簡便に開閉を行うことが可 能である.シャッターの開閉スピードはともに80ミリ秒以 下である.X線画像検出器は,他の放射光X線画像計測同 様に、シンチレータによる可視光変換型の画像検出器であ り、実効画素サイズ数ミクロン以上の計測に対応するため、 タンデムレンズ系を用いた可視光光学系を採用している.し かし,高エネルギー領域のX線では,厚いシンチレータを 容易に透過してしまうため、可視光光学系の配置に注意が必 要となる.また、高分解能測定のためには、実効画素サイズ に対する可視光光学系の光学的性質(シンチレータ厚みと実 効的な焦点深度の関係など)も考慮する必要がある.視野幅 50 mm まで測定可能な高エネルギーX線画像計測専用に開 発した画像検出器では、シンチレータを透過したX線から の散乱の影響を低減させるために、水平面内において、X 線の光軸と直交するように可視光光学系の光軸を設定してい る<sup>(17)</sup>. 可視光光学系を介して画像を検出するカメラには, 高精細カメラを用いることで、広く・細かく撮影することが 可能となる. 高精細 CMOS カメラには、浜松ホトニクス社 製のC13949-50U(画素数4096(H)×3008(V), 画素サイズ 3.45 µm×3.45 µm, 12bit ADC) や Baumer 社製の VCXU-201M.R(画素数5472(H)×3648(V), 画素サイズ 2.4 µm× 2.4 µm, 12bit ADC)などが利用可能である. 使用するビー ムモニターやシンチレータ、可視光光学系の倍率を変えるこ とにより、広視野計測から高分解能計測まで対応することが 可能であり、計測条件例を挙げると、実効画素サイズ12.1 µm/pixel で視野幅 49.6 mm, 実効画素サイズ 3.99 µm/pixel で視野幅 16.3 mm といった測定が可能である. なお, 投



図5 BL28B2における高エネルギーX線マイクロCT装置の模式図と照射X線のスペクトル.(オンラインカラー)

特



図6 高エネルギーX線マイクロCT装置で撮影された石灰 岩の超高精細CT像.(オンラインカラー)

影像の縦方向の視野幅は、光源からの高エネルギーX線の 放射幅に依存しており, BL28B2 における X 線マイクロ CT 測定位置(光源から45m地点)における縦有効幅はおよそ 1.5 mm である. 画像1枚あたりの撮影にかかる露光時間は 概ね30ミリ秒程度であり、CT 撮影1回あたりの測定に要す る時間は5分前後である.ただし、上記のように、視野縦 幅の有効領域は 1.5 mm であるため, ボリュームデータの測 定のためには、試料を鉛直方向にステップ走査して、繰り返 し CT 測定を行う必要がある.測定例として,石灰岩の高エ ネルギーCT 像を図6に示す. 実効画素サイズは2.36 µm として、オフセットスキャン法を併用することにより、更な る高精細計測を行った.投影数は7200投影である.図6に 示した石灰岩の断層像は、10,549×10,549画素によって構成 されており,右上に示した四角で囲った領域の拡大像では, 直径 150 µm 程度の微小な含有物のスポーク状の構造も明瞭 に測定できている.

#### 3. 4**D**-**CT**

放射光 X 線イメージングでは高い光東密度の X 線を利用 し、計測時間が短くできる.空間分解能(検出器の画素サイ ズ)や用いる X 線エネルギーにもよるが、最近では投影像1 枚当たりの露光時間が1ミリ秒以下となるケースも出てく るようになった<sup>(18)(19)</sup>.こうなると単純に時間分解能を持っ た CT 計測が可能となる.これは最近では 4D-CT と呼ばれ るようになってきた.放射光 X 線を利用した 4D-CT には一 っ大きな利点がある.X線の平行性が高く、試料と検出器 の距離をある程度長くとっても、画像検出器に写る像(特に サイズ)はそれほど変化しないことである.これにより、電



図 7 BL20B2 におけるその場観察 CT 装置の様子.(オンライ ンカラー)

気炉や引張試験機など種々の材料試験機の設置が可能とな る<sup>(20)(21)</sup>.また,観察する事象も多岐にわたる.前述の破壊 や変形などの不可逆変化が起こるような材料試験はもちろ ん,弾性変形のように繰り返しの動作が可能な事象や呼吸・ 心電同期を行った小動物のCT撮影なども実施されてい る<sup>(22)</sup>.不可逆変化の観察のためにはいかに試料を高速で回 転させるか,ということを考慮する必要がある.つまり,精 度良く回転するステージとその回転運動に耐えられる試料を 用いなければならない.現状では数Hz(100ミリ秒より長い 時間分解能)程度のCT像の撮影が一般ユーザーに供されて いるようである.一方で可逆変化である現象の観察はタイミ ングさえきちんと合わせれば,ミリ秒の時間分解能での計測 が十分可能である.

本項では、SPring-8 BL20B2で製作されたその場観察 CT 装置(神津精機製 SPU-12)の概要とそれを使った実験例を示 す<sup>(23)</sup>. 図7は、実験装置の写真である.実験ハッチには、 試料ステージとX線画像検出器が設置されている.実験ハ ッチでは、幅20mm以上、高さ3mm以上の大きなビーム を使用することができる.試料位置での光束密度は、25 keVのX線で $1.5 \times 10^9$  photons mm<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>程度である.今 回の実験は25 keV で行われたが、15 keV~37 keV の範囲 であれば問題なく利用可能である.

SPU-12では、数マイクロメートルの分解能(動作精度)を 実現している. 試料回転ステージの最高回転速度は毎秒20 度以上.上下にZステージを配置し、試料に一方向性の荷 重がかけられる.最大荷重は2kNである.上下の回転ステ ージを独立に動作させ、試料をねじることも可能である.

X線画像検出器は、ビームモニター AA60P(浜松ホトニ クス)と科学計測用 CMOS カメラ(ORCA Flash 4.0, 同社) で構成されている. ビームモニターは、薄膜蛍光面(厚さ 20  $\mu$ m の P43(Gd<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Tb<sup>+</sup>)粉末)と可視光光学系(f=105 mm レンズ)で構成されている. カメラには f=50 mm のレンズ が搭載されており、その結果実効画素サイズは 13.2  $\mu$ m/ pixel となった. 画像のフォーマットは2048×2048, ADC



図8 SBR を引っ張りながら撮影した CT 像. 数字は撮影開始からの時間(秒)を表す. (a) (a) 各時刻の X 線透過画像. (b) サン プルの中心で仮想的に切断した X 線 CT 画像. (c) 2 本のピンの中間点での CT 画像. (オンラインカラー)

は16ビットである.測定中,試料ステージは一定の速度で 回転し続けている. パルスモーターコントローラ(PM16C-04-XDL, ツジ電子)から0.2度毎にカメラに対してトリガ信 号が出力される.この実験では、一方向荷重時の移動速度を 2µm/sec としたが, これは CT 1 回当たりの撮影時間(7.5 秒)に動く量を検出器の空間分解能以下にさせるためであ る. 試料はシリカ粒子(20 nm)を付着させたスチレン・ブタ ジエン・ゴム(SBR)で、厚さ1mmのSBR を金属棒の先端 に接着剤で貼り付けた.図8にこの装置で得られたX線画 像を示す. (a)(b)(c)はそれぞれ単純投影像, 試料の縦断層 像(試料中心部での virtual slice)および,SBR の中心位置で の CT 像となっている. (a) と(c)の図の横にある数値は測定 開始からの時間(秒)を表している.開始から200秒ほど経過 (引張の距離は 400 µm 程度)したころからボイドが発生し始 めた. 500秒を過ぎるころには、たくさんのボイドが発生し ていることがわかる. さらに CT 撮影中でも計測系の空間分 解能以下の変形は画質に影響しないこと、常にゆっくりと変 形させることで粘弾性体が緩和することを防げていることが 分かる.

#### X線CTのこれからの課題 —3D 画像処理および 画像解析—

X線CTは試料の透過像を画像再構成し断層像を作るまで が計測であると考えられる.つまり再構成画像(CT像)が生 データと言える.試料由来あるいは試料環境由来の計測の難 しさはあるが、サンプリング定理をはじめとする変換に対し ての基本式は確立しているし、最近ではGPGPUを利用し

た画像再構成ソフトも充実しており、ほぼストレートに実施 可能である.難しいのはここから先の処理である.例えばデ ータ量であるが、2048×2048画素のカメラを使った場合、 CT 像1枚当たり2048×2048画素になるので,16bit 画像で あれば8MB, これが2048枚重なると16GBとなる.これ が4096×3008画素のカメラを使うと96GBになる.これを データ取得用計算機から画像処理用計算機に転送するのに相 当な時間がかかる. さらに, 3D データから必要な情報を抽 出するためのノイズフィルター適用, Erosion-Dilation 処理 やセグメンテーションもかなりの計算機資源を必要とする. また,通常CT撮影は1回で終わることはなく,一般的なケ ースでも1日に50-60スキャン行うことはザラであり、撮影 を進めながら前述の処理を遅滞なく進めることは難しい. つ まり、これらを高速かつ自動で処理するような仕組みが必要 とされるようになってきた. 機械学習を利用したノイズ除去 やセグメンテーションの研究も精力的に進められているが、 個々の研究事例に対する適用はできているものの、ユニバー サルに適用できるようなものはまだ登場しておらず, 試料タ イプや条件に応じて何度も学習をやり直す必要がある.計算 能力の向上や転送速度の向上を含めたハードウエアの進化も 重要だが、新しいアルゴリズムを利用した画像処理のソフト ウエアが登場することを期待したい.

#### 5. おわりに

本稿では SPring-8 における放射光 X 線 CT の最近の進展 を中心に記述した. X 線 CT は世界中の放射光施設で開発・ 利用されておりその成果はめざましい. ラボ用の CT 装置も 非常に高いレベルに到達しており,今後の発展も期待でき る.さらに,中性子線CT,TEM-CT,MRIなどといった イメージング技術が進歩しており,それらの情報が相互に参 照できるのが理想的であろう.それらの技術を結ぶのは,装 置の利用者諸氏および新しい発想に基づいたソフトウェア開 発者である.これからの連携強化に期待したい.

#### 文 献

- (1) G. N. Hounsfield: Br. J. Radiology, 46(1973), 1016–1022.
- (2) https://www.bruker.com/ja/products-and-solutions/ microscopes/3d-x-ray-microscopes/skyscan-1272.html (2021.11.25現在)
- (3) https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/x-raymicroscopy.html(2021.11.25現在)
- (4) https://japan.rigaku.com/ja/products/xrm(2021.11.25現在)
- (5) M. Ge, D. S. Coburn, E. Nazaretski, W. Xu, K. Gofron, H. Xu, Z. Yin and W. K. Lee: Applied Physics Letters, 113(2018), 083109.
- (6) G. Martínez-Criado, J. Villanova, R. Tucoulou, D. Salomon, J.-P. Suuronen, S. Labouré, C. Guilloud, V. Valls, R. Barrett, E. Gagliardini, Y. Dabin, R. Baker, S. Bohic, C. Cohen and J. Morse: J Synchrotron Radiat, 23 (2016), 344–352.
- (7) V. De Andrade, A. Deriy, M. Wojcik, D. Gürsoy, D. Shu, T. Mooney, K. M. Peterson, A. Glowacki, K. Yue, X. Yang, R. Vescovi and F. D. Carlo: Proc. SPIE, **9967**(2016), 99670H.
- (8) A. A. MacDowell, D. Y. Parkinson, A. Haboub, E. Schaible, J. R. Nasiatka, C. A. Yee, J. R. Jameson, J. B. Ajo-Franklin, C. R. Brodersen and A. J. McElrone: Proc. SPIE, 8506(2012), 850618.
- (9) M. Stampanoni, A. Groso, A. Isenegger, G. Mikuljan, Q. Chen, D. Meister, M. Lange, R. Betemps, S. Henein and R. Abela: AIP Conference Proceedings, 879(2007), 848.
- (10) A. Takeuchi and Y. Suzuki: Microscopy, **69**(2020), 259–279.
- (11) A. Takeuchi, K. Uesugi, M. Uesugi, H. Toda, K. Hirayama, K. Shimizu, K. Matsuo and T. Nakamura: Rev. Sci. Instrum, 92 (2021), 023701.
- (12) A. Takeuchi, K. Uesugi, M. Uesugi, F. Yoshinaka and T. Nakamura: Microsc. Microanal, 24(2018), 106–107.
- (13) A. Tsuchiyama, M. Uesugi, T. Matsushima, T. Michikami, T. Kadono, T. Nakamura, K. Uesugi, T. Nakano, S A. Sandford, R. Noguchi, T. Matsumoto, J. Matsuno, T. Nagano, Y. Imai, A. Takeuchi, *et al.*: Science, **333**(2011), 1125–1128.

- (14) F. Yoshinaka, T. Nakamura, S. Nakayama, D. Shiozawa, Y. Nakai and K. Uesugi: Int. J. Fatigue, 93(2016), 397–405.
- (15) 例えば東芝 IT コントロールシステム株式会社(https://www. toshiba-itc.com/hihakai/toscaner-20000/),株式会社ニコンソ リューションズ(https://www.nsl.nikon.com/jpn/industrialproducts/xray-ct-inspection/ct/xt-h-450), YXLON International (https://www.yxlon.co.jp/ja/products/x-ray-and-ctinspection-systems/yxlon-ct-compact-ja)(2021.11.25現在)
- (16) M. Hoshino, K. Uesugi, R. Shikaku and N. Yagi: AIP Advances, 7(2017), 105122.
- (17) M. Hoshino, K. Uesugi and N. Yagi: J. Synchrotron Rad, 27 (2020), 934–940.
- (18) E. Maire, C. L. Bourlot, J. Adrien, A. Mortensen and R. Mokso: Int J Fract, 200 (2016), 3–12.
- (19) M. P Olbinado, V. Cantelli, O. Mathon, S. Pascarelli, J. Grenzer, A. Pelka, M. Roedel, I. Prencipe, A. L. Garcia, U. Helbig, D. Kraus, U. Schramm, T. Cowan, M. Scheel, P. Pradel, *et al.*: J. Phys. D: Appl. Phys., **51** (2018), 055601
- (20) H. Toda, H. Oogo, K. Horikawa, K. Uesugi, A. Takeuchi, Y. Suzuki, M. Nakazawa, Y. Aoki and M. Kobayashi: Metall. Trans. A: 45 (2014), 765–776.
- (21) S. Okumura, M. Nakamura, K. Uesugi, T. Nakano and T. Fujioka: Earth and Planetary Science Letters, 362(2013), 163– 170.
- (22) T. Sera, K. Uesugi, R. Himeno and N. Yagi: Respiratory Physiology & Neurobiology, 156 (2007), 304–311.
- (23) K. Uesugi, M. Hoshinio, H. Kishimoto and R. Mashita: Proc. SPIE, 9967 (2016), 99670V.

#### 

2000年3月 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程中退

2000年4月 財団法人 高輝度光科学研究センター 放射光研究所 研究員 2017年10月 公益財団法人 高輝度光科学研究センター 主席研究員(現職) 専門分野:X線マイクロCT とその応用

◎SPring-8 にてビームライン担当者として活動. X 線 CT 装置および X 線画 像検出器の開発に従事.

\*\*\*\*\*\*\*





星野真人



竹内晃久

上杉健太朗

ま て り あ 第61巻 第2号(2022) Materia Japan



#### 三次元組織解析の最前線 後編

## 3次元アトムプローブ解析法の最近の進展

佐々木泰祐1 埋橋 淳2 大久保忠勝3 宝 野 和 博4

#### 1. はじめに

3次元アトムプローブ(3DAP)は、電界イオン顕微鏡 (FIM)から発展した飛行時間型質量分析装置で、図1に示 すように直径100 nm 程度の針状試料(tip)先端から原子を一 個ずつ電界蒸発させ、位置敏感型検出器に向かって放出され るイオンの飛行時間質量測定により原子種の同定と位置測定 (x<sub>i</sub>, y<sub>i</sub>)を同時に行う、イオンが検出される順序iは原子の深 さ座標 z<sub>i</sub>に対応するので、得られた原子種と(x<sub>i</sub>, y<sub>i</sub>, z<sub>i</sub>)から3 次元原子マップ、つまりアトムプローブトモグラフィー (APT)を構成することができる<sup>(1)</sup>.近年、X線マイクロト モグラフィーや電子線トモグラフィーが汎用的な材料解析手 法として普及し始めているが、APTは3次元空間の原子を 直接観察できることから、透過像のコントラストから3次 元画像を構成するX線・電子線トモグラフィーとは本質的 に異なる.

2000年代初頭までのアトムプローブでは、針状試料に DC の高電圧を印加し、これに ns の電圧パルスを重畳させて原 子を電界蒸発させていたため、解析可能な材料は導電性材料 に限定されていた<sup>(2)</sup>. 2004年に Rouen 大学の Deconihout らは電界蒸発の補助に超短パルスレーザーを用いると、電圧 パルス駆動と同質の 3DAP データが得られることを示し た<sup>(3)</sup>. 同時期に NIMS のグループは、レーザー波長を赤外 域から紫外域へと短波長化すると絶縁体バルク材料からも 3DAP 解析が可能になることを報告し<sup>(4)</sup>、3DAP 解析の適用 可能範囲が導電性材料から絶縁体にまで広がるきっかけとな った. また、最近の商用機では、位置敏感検出器の改良によ り従来わずか30~40%程度であった検出効率が最大で80%



程度にまで劇的に上昇したり、10年前まではせいぜい数百 万原子程度の3DAPデータしか取得できなかったところ が、現在では高速信号処理によって数千万から数億原子とい った広領域からの3DAPデータが短時間で取得できるよう になった.このような装置面での革新に加え、集束イオンビ ーム装置(FIB)を用いた針状試料作製法の発展により、 3DAP または APT を用いた材料解析事例が増えてきてい る.とはいえ、3DAP で分析できる領域はナノ領域に限定さ れること、また回折による構造情報が得られないことから、 材料解析で意味ある情報を得るためには透過型電子顕微鏡 (TEM)との相補的利用が不可欠である.本稿では、3DAP と TEM を相補的に用いた材料組織解析の例を示し、ここ 10年程度の3DAPを用いたナノ組織解析の進歩について述 べる.

#### 2. 3DAP 解析の強み~ナノ結晶軟磁性材料の解析~

一般に、ナノスケールの微小な領域の構造や元素分布を解

<sup>\*</sup> 国立研究開発法人物質・材料研究機構;1)主幹研究員 2)主任エンジニア 3)副拠点長 4)フェロー(〒305-0047 つくば市千現 1-2-1) Recent Advances in 3D Atom Probe Analysis; Taisuke Sasaki, Jun Uzuhashi, Tadakatsu Ohkubo and Kauhiro Hono(Research Center for Magnetic and Spintronic Materials, National Institute for Materials Science, Tsukuba) Keywords: *three-dimensional atom probe (3DAP), transmission electron microscope (TEM), focused ion beam (FIB), structural materials, functional materials* 

<sup>2021</sup>年11月12日受理[doi:10.2320/materia.61.72]



図2 Fe-P-B-Cuナノ結晶軟磁性材料の(a) 明視野 TEM 像,(b) スライスした3次元原子マップ,(c)(b)内の 矢印からの組成プロファイル,(d)α-Fe結晶粒を取り 囲んで銅クラスターが形成されている様子<sup>(5)</sup>.図2(d) では,銅クラスターの視認性をよくするため等濃度曲 面でクラスターを描画した.

析する際は,(走査)透過型電子顕微鏡((S)TEM)解析に EDS や EELS などの元素分析を組み合わせた解析を行う. しかし,TEM 試料の膜厚(一般的に50 nm 前後)より小さな サイズの原子クラスターや析出物,ナノ結晶などをTEM に より定量的に評価することは極めて難しい.3DAP は数十 ppm という検出限界と原子レベルに近い空間分解能で,母 相に埋もれたナノ領域の軽元素を含む元素分布を定量的に評 価できるという,他の解析手法にはない特長がある.

図 2(a)は Fe-P-B-Cu ナノ結晶軟磁性材料の明視野 TEM 像である<sup>(5)</sup>. 10 nm 程度の微細な α-Fe 結晶粒がアモルファ ス母相中に分散している様子を観察できるが, B を含む溶質 元素がこのナノ結晶とアモルファス相でどのように分布して いるのかが材料設計上必要な情報である.図2(b)はこの試 料を 3DAP で観察した結果得られた 3 次元原子マップであ る. なお, 個々の原子が見えるように2nm にスライスした 領域の原子のみが示されている. B, P 原子の分布から α-Fe ナノ結晶が明瞭に観察される. 矢印で示す方向に濃度プロフ ァイルを描くと、図2(c)に示す通り、α-Fe 結晶粒とそれら を取り囲むアモルファス相の元素分布を定量的に評価でき る.ナノ結晶の組成は Fe<sub>96.2</sub>P<sub>2.6</sub>B<sub>0.6</sub>Cu<sub>0.6</sub> で微量の P と B が 固溶した α-Fe 相, 溶質元素は残存アモルファス相に Fe<sub>74.5</sub> P<sub>17.0</sub>B<sub>8.2</sub>Cu<sub>0.3</sub>の組成で濃化することによりアモルファス相が 安定化している. さらに,図2(d)では,TEM 像からは確 認できない数 nm のサイズの銅クラスターが α-Fe 結晶粒の 周囲と α-Fe 内部に形成していることも確認でき、多くのナ ノ結晶軟磁性材料で報告されてきたように<sup>(6)</sup>,この銅クラス ターが α-Fe 結晶粒の不均一核形成サイトとして作用したこ とを示唆している.

このように、3DAP はナノサイズの組織の元素分布に関する定量的な知見が得られることに加え、TEM では定量が困

難なクラスターの数密度などの組織因子を評価できる.一 方,取得したデータを3次元再構築する際のパラメータ設 定には任意性があるため,3DAPデータだけで組織の実際の 形状やサイズが再現できないことがある.よって,TEMと 3DAPの特長を相補的に活用するとことで,ナノ組織の定量 解析が可能となる.

#### 3DAP 試料作製技術の発展~任意領域からの 3DAP 解析

3DAP 用の針状試料はかつて電解研磨法により作製されて いた<sup>(2)</sup>. そのため,結晶粒界や異相界面などは電解研磨中に 偶然試料の先端に出現しない限り分析できないという,試料 中の特定領域解析においては決定的な弱点があった.通常, ミクロサイズの多結晶試料では,電解研磨で結晶粒界を分析 できる確率は1%にも達しない.このような3DAPの制約 を克服するために,Larsonらは,FIB/SEMを用いて特定 の領域から3DAP 試料を作製する技術を確立した<sup>(7)</sup>.この FIB/SEM による特定領域からの針状試料作製が可能になっ たことで,結晶粒界や異相界面などの局所領域からの3DAP 解析も日常的に行うことができるようになった.

図3(a)に9Cr 耐熱鋼の旧オーステナイト粒界付近のSEM 像を示す.FIBを用いて矢印で示す領域をリフトアウトし (図3(b)),図3(c)に示すようにFIBの環状加工を用いて旧 オーステナイト粒界が針状試料に含まれるように加工した後 3DAP 解析を行った結果,ボロンが旧オーステナイト粒界に 偏析する様子を明瞭に観察できた(図3(d)).また,図3(c)



 図3 (a) 9Cr 耐熱鋼の旧オーステナイト粒界を含む2次電子 SEM 像,(b) (a)中の矢印で示す領域からリフトアウト した3DAP 試料,(c) (b)を針状に加工した後のSEM 像,(d) (c)で示した試料より得た3次元アトムマッ プ.青い等濃度面でFe<sub>2</sub>W粒子を,緑の等濃度面で NbC粒子を表示した.

に見られる粒子状の Fe<sub>2</sub>W 相が3次元原子マップ上で青い 等濃度面で表示した粒子として観察されるだけでなく,反射 電子 SEM 像では観察が難しい NbC 相が粒界上に析出する 様子が緑の等濃度面で表示した粒子で観察される.さらに, これらの第2相粒子と母相の界面にボロンが偏析した様子 まで観察することができる.

#### 4. TEM と 3DAP による同一視野解析手法の高度化

FIB/SEM を用いた試料作製法の発展により,簡便に高度 な TEM と 3DAP による同一視野解析が行えるようになっ た.局所電極を備えた商用の局所電極アトムプローブ (LEAP)では,TEM 試料を担持するグリッドを分析室に持 ち込めるため,FIB で針状試料を TEM グリッド上に作製し, TEM 観察後,同一領域からの 3DAP 解析が可能である(図 4).

TEM との同一視野解析が必須の解析例として、転位や積 層欠陥への溶質元素の偏析がある.鉄鋼材料では炭素が転位 に偏析して転位運動を固着するが、転位芯への炭素やボロン など軽元素の偏析を(S)TEM で分析することは難しい.一 方、転位を含む試料のTEM/3DAP 同一視野解析を行うと、 TEM により試料内に含まれる転位を同定してから 3DAP 解 析を行えるため、転位芯への合金元素偏析を直接観察できる.

図5(a)は、溶体化処理後、引張試験により2%の予ひず



図4 TEM グリッド上に FIB/SEM を用いて作製したマグネ シウム合金の 3DAP 解析試料を TEM と 3DAP で同一 視野を解析する様子.

みを導入後,170℃で20分の時効処理を行った Mg-1.2Al-0.8Zn-0.5Mn-0.5Ca (mass%) (AZMX1100) 合金圧延材の 3DAP 解析前の試料の明視野 TEM 像である<sup>(8)</sup>.この試料 は、塗装焼付け硬化を示すマグネシウム合金板材として注目 される新合金である. EBSD を用いて予め試料の結晶配向 を解析し、マグネシウム母相の[0001]方向が試料面直方向 に配向した結晶粒から針状試料を作製したため、明視野 TEM 像中のa~dで示す底面<a>転位のコントラストが 分析方向にほぼ垂直となっている(図5(b)). この領域から 得た3次元原子マップでは、全体に均一に分布するZnと Ca のクラスターに加え、合金元素が線状に濃化した領域が 観察される.明視野 TEM 像と0.48 at%の等濃度面を使って Caの分布を強調した3次元原子マップを重ねると、図5(c) のように,明視野 TEM 像の中の転位のコントラストと3次 元原子マップ中の Ca と Zn が濃化した線状のコントラスト が一致することから、Ca と Zn が転位芯に偏析しているこ とが分かる.図5(d)には図5(c)中の矢印で示した等濃度面 からの溶質元素の濃度変化を示しており、転位芯には Ca に 加えて Al と Zn が偏析している. この 3DAP 解析結果によ り、この合金での短時間時効による硬化は、Ca、Al、Zn が 転位に偏析して固着したことが原因であることが示された.

#### 5. 3DAP 解析の応用範囲の広がり~金属材料から無 機物,有機物へ~

3DAP 解析により解析できる材料は金属に限らず,半導体 などの解析も可能である<sup>(9)</sup>.ここでは,その一例として, GaN 半導体の 3DAP 解析結果について紹介する.GaN は次 世代パワー半導体として期待されており,現在,Mg イオン を注入することで p型半導体を作製する方法が有力視され ている.これまでに,Mg イオンの注入により転位や空孔が 導入され,それらの欠陥の修復と Mg 活性化のための熱処 理プロセスで Mg の欠陥中への偏析が起こることは TEM-EDS によっても報告されていた<sup>(10)</sup>.しかし,注入する Mg の濃度はたかだか0.01 at%以下のオーダーであることから, Mg のクラスター形成については不明な点が多かった.図6



図5 ひずみ時効処理を行った試料から作製した 3DAP 試料の(a) 明視野 TEM 像と,それから得た(b) 3 次元原子マップ<sup>(8)</sup>.
 (c)は(b)を0.48 at%Ca の等濃度面を用いて溶質クラスタと転位芯への溶質元素の偏析を強調し,(a)と重ね合わせた図.
 図5(c)中の矢印で示した等濃度面の近傍における溶質濃度変化を示す proximity diagram.



3DAP 解 析 試 料 の (a) LAADF - STEM 像, (b) LAADF-STEM 観察した領域より得た Mg の 3 次元原 子マップ, (c) (a) および (b) を重ね合わせた像<sup>(11)</sup>.

(a)は Mg イオンを 1×10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup>(約0.01 at%)注入したのち, 1300℃で熱処理した GaN の 3DAP 解析用試料の低角環状暗 視野 STEM (LAADF-STEM) 像である<sup>(11)(12)</sup>. この観察手 法では格子歪みなどに起因する欠陥が明るいコントラストと して観察される. この 3DAP 試料から取得した 3 次元の Mg 原子マップ(図 6(b))より, Mg 原子の分布を精緻に知る ことができる. 図 6(c)に示すように STEM 像と 3DAP よ り得た Mg の原子マップを重ね合わせると,転位ループへ の Mg の偏析に加え,高密度の Mg のクラスターが形成さ れていることが明瞭に観察され,それが Mg のドーパント としての効果を不活性にしている原因であることが示された.

これまで示してきた例は金属や半導体などの無機材料の例 ばかりだが、紫外光短波長レーザーによる電解蒸発の補助 は、有機物を含む材料の3DAP解析さえも可能にし た<sup>(13)(14)</sup>. そこで,最近我々が行った豚の歯の 3DAP 解析の 例を示す(15). 一般的に歯と聞いて思い浮かべるのは、「エナ メル質」と呼ばれる生体でもっとも硬い組織であるが、「象 牙質」はその内部に存在し、ヒドロキシアパタイト Ca5 (PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH)というカルシウム主成分の繊維形状の結晶とコ ラーゲンなどの有機物から構成される.図7(a)に示すのは 豚の歯の象牙質で熱処理によって含まれる有機物を乾燥させ た後に取得した高角環状暗視野(HAADF-STEM)像で、こ こでは繊維形状のヒドロキシアパタイト結晶が確認できる. 実際にはこの繊維状ヒドロキシアパタイトの隙間部分は有機 物と水分とで満たされている. この試料を 3DAP で解析す ることにより得られた3次元原子マップが図7(b)である. 図では視認性向上のため等濃度曲面により描画している.分 析結果の詳細については本題から外れるので参考文献をご覧 いただきたいが、有機物を約30%含むような材料の3DAP 解析さえも昨今は可能になった.

冒頭で述べた通り,3DAP は飛行時間型質量分析なので, EDS や EELS などでは分析ができない水素を含む全ての元



 図7 (a) 豚の歯の象牙質を熱処理後に撮影したヒドロキシア パタイト Ca<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH)の HAADF-STEM 像, (b) 熱処理前の象牙質(無機質ヒドロキシアパタイト70%, 有機物30%)より得た3次元原子マップ(等濃度曲面に より描画)<sup>(15)</sup>.



図8 (a) HDDR 処理を施したネオジム磁石粉末中のネオジ ム水素化物(NdH<sub>2</sub>)の 3DAP 解析の例<sup>(16)</sup>.

素を分析できる.図8(a)に示す通り,水素を吸蔵させたネ オジム磁石粉末を3DAPで分析すると,粉末中に形成する ネオジム水素化物(NdH<sub>2</sub>)中の水素が定量的に分析できてい る<sup>(16)</sup>.このように質量分析で元素を同定するアトムプロー ブでは検出効率に質量依存性がなく,軽元素の定量分析がで きるという特長がある.一方,水素は超高真空中の残留ガス の主な元素であることから,水素を定量分析するためには試 料先端からイオン化される残留ガスか試料に固溶していた水 素かを区別する必要がある<sup>(16)-(18)</sup>. この問題を解決するた めに,高橋らは,残留ガスとは異なる質量電荷比を有する重 水素をチャージした鉄鋼材料の 3DAP 分析を行い,鋼中に 分散した TiC 析出物にトラップされた水素の 3DAP 観察に 成功した<sup>(19)</sup>.最近では,Oxford 大学や Max-Planck Institute のグループが鉄鋼材料中の析出物や転位などへの水 素トラップの観察例を報告するなど,現在,3DAP のコミュ ニティでは微量水素の分布の解析がホットな研究テーマにな りつつある<sup>(20)(21)</sup>.低温での FIB 加工が可能なクライオ FIB/SEM 複合装置や,クライオ FIB/SEM 複合装置から大 気非暴露かつ低温維持で 3DAP 装置へ試料挿入可能なモジ ュール(VCTM)なども市販されるようになっており,微量 な水素の存在状態の解明への 3DAP 解析の積極的な適用が 今後さらに広がるものと思われる.

レーザーアシスト, 高速信号処理, FIB/SEM による微細 加工,TEM/3DAP 同視野解析,微量水素の分析など,近年 の 3DAP または APT は目覚ましい発展を遂げているが,分 析の効率化と再現性にはまだ課題が残る. FIB/SEM を用い た試料作製には熟練した経験が必要である. 試料形状により 検出器上への投影領域が大きく変化するだけでなく、レーザ ーアシスト電界蒸発では熱伝導の影響が分析の定量性にも大 きく影響する. 3DAP データを再現性良く収集するために は、一定形状の試料を作製する熟練技術が必要とされる. そ こで、NIMS では熟練技術に頼ることなく一定して質の高 い 3DAP 分析を行える環境を整えるため, FIB/SEM によ る試料作製の自動化に向けた取り組みを進めている. 最新の FIB/SEM には Python 等のスクリプトによる自動操作を可 能にする機能が備わっており、これを活用すれば、図9に示 すように 3DAP 試料作製の自動化が可能になる.まず図9 (a) で FIB 加工の指示を出し,図 9(b) のように FIB 加工を 実行,加工終了後に自動的に図9(c) SEM 像を取得して



図9 (a)スクリプトによる自動制御可能な FIB/SEM 複合装 置から FIB 加工を装置に指示し,(b) FIB により針状 加工を行ったのち,(c) 側面から SEM 像を観察し形状 を認識し,次のステップを自動判断する工程の模式 図.(オンラインカラー)

3DAP 試料の形状を認識させ、次の工程を自動判断し試料作 製を進める.こうした 3DAP 試料自動作製の本格運用が始 まれば、熟練工の巧の技にたよることなく、3DAP 分析を効 率的にかつ再現性良く行えるようになると期待される.

#### 6. ま と め

3DAP 解析技術はここ10年程度で飛躍的な進歩を遂げた. FIB/SEM を用いた局所領域からの試料作製法の進歩や TEM との同一視野解析の高度化によって,現在では解析し たい領域からの 3DAP 解析がルーチーン的に行えるように なった.また,紫外光レーザーによる電界蒸発のアシストに より,3DAP 解析が適用可能な材料は,金属材料などの導電 性のある試料から絶縁体試料や生物試料にまで拡大した.こ の進化した 3DAP 解析を適用することで,広範な材料の原 子トモグラフィーの可視化とそのデータからの定量分析が可 能となってきている.より詳細は,最近出版された教科書を 参考にされたい<sup>(22)</sup>.

#### 文 献

- A. Cerezo, T. J. Godfrey and G. D. W. Smith: Rev. Sci. Instrum., 59(1988), 862–866.
- (2) M. K. Miller: Atom Probe Tomography, Springer US, Boston, MA, (2000).
- (3) D. Deconihout, F. Vurpillot, B. Gault, G. Da Costa, M. Bouet and A. Bostel: IFES04 Progr. Abstr., Graz, (2004), 84.
- (4) Y. M. Chen, T. Ohkubo, M. Kodzuka, K. Morita and K. Hono: Scr. Mater., **61**(2009), 693–696.
- (5) Y. Nomura, J. Uzuhashi, T. Tomita, T. Takahashi, H. Kuwata, T. Abe, T. Ohkubo and K. Hono: J. Alloys Compd., 859 (2021), 157832.
- (6) K. Hono, D. H. Ping, M. Ohnuma and H. Onodera: Acta Mater., 47 (1999), 997–1006.
- (7) K. Thompson, D. Lawrence, D. J. Larson, J. D. Olson, T. F. Kelly and B. Gorman: Ultramicroscopy, **107** (2007), 131–139.
- M. Z. Bian, T. T. Sasaki, T. Nakata, Y. Yoshida, N. Kawabe, S. Kamado and K. Hono: Acta Mater., 158(2018), 278–288.
- (9) S. E. Bennett, R. M. Ulfig, P. H. Clifton, M. J. Kappers, J. S. Barnard, C. J. Humphreys and R. A. Oliver: Ultramicroscopy, 111(2011), 207–211.
- (10) K. Iwata, H. Sakurai, S. Arai, T. Nakashima, T. Narita, K. Kataoka, M. Bockowski, M. Nagao, J. Suda, T. Kachi and N. Ikarashi: J. Appl. Phys., **127** (2020), 105106.
- (11) A. Kumar, W. Yi, J. Uzuhashi, T. Ohkubo, J. Chen, T. Sekiguchi, R. Tanaka, S. Takashima, M. Edo and K. Hono: J. Appl. Phys., **128**(2020), 065701.
- (12) A. Kumar, J. Uzuhashi, T. Ohkubo, R. Tanaka, S. Takashima, M. Edo and K. Hono: J. Appl. Phys., **126** (2019), 235704.
- (13) L. M. Gordon, M. J. Cohen, K. W. MacRenaris, J. D. Pasteris, T. Seda and D. Joester: Science, **347** (2015), 746–750.
- (14) L. M. Gordon, L. Tran and D. Joester: ACS Nano, 6(2012), 10667–10675.
- (15) J.-B. Forien, J. Uzuhashi, T. Ohkubo, K. Hono, L. Luo, H. P. Schwarcz, A. C. Deymier, C. Krywka, C. Fleck and P. Zaslansky: Acta Biomater., **120**(2021), 91–103.
- (16) H. Sepehri-Amin, T. Ohkubo, T. Nishiuchi, S. Hirosawa and K. Hono: Ultramicroscopy, **111** (2011), 615–618.
- (17) J. Takahashi, K. Kawakami, H. Otsuka and H. Fujii: Ultramicroscopy, **109** (2009), 568–573.
- (18) R. Gemma, T. Al-Kassab, R. Kirchheim and A. Pundt:

Ultramicroscopy, 109 (2009), 631-636.

- (19) J. Takahashi, K. Kawakami, Y. Kobayashi and T. Tarui: Scr. Mater., 63 (2010), 261–264.
- (20) Y.-S. Chen, D. Haley, S. S. A. Gerstl, A. J. London, F. Sweeney, R. A. Wepf, W. M. Rainforth, P. A. J. Bagot and M. P. Moody: Science, 355(2017), 1196-1199.
- (21) A. J. Breen, L. T. Stephenson, B. Sun, Y. Li, O. Kasian, D. Raabe, M. Herbig and B. Gault: Acta Mater., 188(2020), 108-120.
- (22) B. Gault, M. P. Moody, J. M. Cairney and S. P. Ringer: Atom Probe Microscopy, Springer New York, (2012).

#### \*\*\*\*\*\* 佐々木泰祐

2008年 筑波大学大学院数理物質科学研究科博士課程修了 主な略歴 物質・材料研究機構 NIMS ポスドク研究員 アラバマ大学 ポスドク

埋橋 淳

2011年4月-現職

専門分野:微細組織解析,軽金属材料,永久磁石 ◎3DAP,TEM,SEMを用いて種々の金属材料の微細組織をマルチスケー ルで解析し,高特性化の指針構築や材料開発を進めている.

\*\*\*\*\*



佐々木泰祐

大久保忠勝

宝野和博



三次元組織解析の最前線 後編

## 中性子イメージングによる3次元可視化技術

#### 篠原武尚\*

#### 1. はじめに

中性子イメージングは中性子ビームを用いた観察技術であ り、X線と同様に観察対象内部の2次元/3次元形状情報を 非破壊で観察する技術である.特に,中性子は電気的に中性 であるために優れた物質透過能力を有するだけでなく、軽元 素に対する高い感度や同位体識別能力を有することから、他 の放射線プローブとは異なる透過画像を与え、水をはじめと する液体の分布や挙動の可視化や、X線が透過できない金 属製の物体の欠陥探査等に利用されてきた. これまで,中性 子イメージング(より厳密には「中性子ラジオグラフィ」)で は、原子炉等の定常中性子源からの白色中性子をそのまま利 用して,透過画像を取得してきた.しかしながら,新しい大 強度の中性子線源の建設や中性子関連デバイスの高性能化に よる中性子線源自体の増強と利用効率の向上により、中性子 エネルギー/波長を選択した単色中性子イメージングが実用 段階になった結果、これまでの中性子イメージングが形状情 報の観察であったのに対して、観察対象内部の物理特性を反 映した画像の取得が可能となった.これは、物質と中性子と の相互作用(吸収, 散乱, 屈折, 反射, 干渉など)の多くは中 性子エネルギー/波長に依存してその大きさが変化するた め,相互作用の結果として生じる中性子透過率変化を画像コ ントラストとして有効に活用することが可能となったことに よる. さらに、エネルギー/波長スキャンにより単色イメー ジングはエネルギー選択型中性子イメージングに発展し、得 られた位置毎の中性子透過スペクトルの解析を通じて観察対 象内部の結晶組織構造の違いの空間分布を可視化することに つながった(ブラッグエッジイメージング)<sup>(1)-(3)</sup>.また,中 性子スピンの情報を利用した磁場イメージングもこの単色中 性子イメージングの実現により可能となった<sup>(4)(5)</sup>.

一方、我が国においては、北海道大学や高エネルギー加速

器研究機構の加速器中性子実験施設においてパルス中性子ビ ームを用いたイメージング技術の開発が進められた.パルス 中性子は中性子の発生時刻からの飛行時間(Time-of-Flight, ToF)の分析によりそのエネルギーを知ることができるた め,飛行時間ごとの画像を取得することによって,原子炉等 からの定常中性子を単色化するのと比較して高いエネルギー 分解能と実験効率を実現することができ,エネルギー依存性 を解析する上では非常に有利であった(このようなイメージ ング法をエネルギー選択とは区別して,エネルギー分析型中 性子イメージング<sup>(6)</sup>と呼ぶ).そして,パルス中性子は定常 中性子と比べて広いエネルギー範囲の中性子を一度に利用す ることができるため, eV から keV 程度のエネルギーを持つ 熱外中性子領域において起こる中性子共鳴吸収反応を用いた 原子核種選択型イメージング<sup>(7)(8)</sup>や対象核種の熱振動状態を 解析する温度のイメージング<sup>(7)(8)</sup>や対象核種の熱振動状態を

このような先行研究を基に J-PARC のパルス中性子実験 施設である物質・生命科学実験施設(MLF)には,世界に先 駆けてパルス中性子イメージング専用実験装置である「エネ ルギー分析型中性子イメージング装置(RADEN)」が建設さ れ,本格的なエネルギー分析型中性子イメージングの実用化 とユーザー利用が開始された<sup>(11)</sup>.本稿ではこのエネルギー 分析型中性子イメージングを利用した3次元での物理的情 報の可視化の研究開発について紹介する.

#### 2. 中性子を用いた3次元可視化技術

最初に、基本的な中性子イメージングについて述べる. 一 般的な中性子イメージングの撮像系はX線イメージングと 同様に、中性子を可視光に変換するシンチレータ、光を中性 子ビーム軸から避けるためのミラー、光学レンズ、そして CCDや CMOS センサーを用いたデジタル画像撮像カメラか ら構成される. 視野範囲は1 cm 角~30 cm 角程度であり、

<sup>\*</sup> 日本原子力研究開発機構 J-PARC センター;研究主幹(〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方 2-4)

Three-dimensional Visualization Technique Based on the Neutron Imaging; Takenao Shinohara (\*J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency, Tokai)

Keywords: *pulsed neutron, energy-resolved neutron imaging, bragg edge, strain tomography, polarized neutron, polarimetric tomography* 2021年11月12日受理[doi:10.2320/materia.61.78]

空間分解能は撮像素子のピクセル数と視野範囲,シンチレー タ厚に依存し,10µm~300µm 程度である.観察対象を回 転させながら透過像を撮像することにより中性子を用いたト モグラフィも可能である.飛行時間分析を用いたイメージン グでは,撮像系に時間分解能が必要であるため,カメラ型で はなくガス検出器等の中性子イベントを記録する2次元検 出器を利用することが多い.中性子イメージングの基本的な 撮像技術については,日本アイソトープ協会刊行の「中性子 イメージングカタログ/中性子施設ハンドブック」に詳しく 説明されているので,興味がある方はこちらを参考された い<sup>(12)</sup>.

さて、X線と中性子の大きな違いは物質との相互作用断 面積の違いであり、先にも述べたように中性子は金属でもよ く透過する.たとえば、X線がほとんど透過しないPbは中 性子にとっては非常に透過しやすい物質であり、また、数 cm厚程度の鉄板でも中性子は容易に透過することができ る.そのため、身の回りの機械部品などがそのまま観察対象 となる.中性子トモグラフィの例としてアルミニウム合金製 鋳造品<sup>(13)</sup>と付加製造技術により製作したマルエージング鋼 製の部品の結果を図1に示す.アルミニウム合金製鋳造品で は内部の空隙が明瞭に観察され、マルエージング鋼製の部品 の観察では厚肉部の部分の空隙率(porosity)の違いや微細構 造の違いによるコントラストが確認されている<sup>(14)</sup>.CT値 の定量性に関しては、白色中性子を用いた場合にはスペクト ルの影響を受けるために絶対値での議論は難しいが、定性的



図1 中性子 CT の実施例.上:アルミニウム合金製鋳造 品<sup>(13)</sup>.(a):外観写真,(b):CT 再構成結果の立面 像,(c):断層像.下:付加製造技術により製作された マルエージング鋼製の部品<sup>(14)</sup>.左:X線CT の結果, 右:中性子 CT の結果.X線は分解能が高く表面の粗さ や先端部の鋭さをよく表現する一方で,中性子では材料 内部の空隙率の違いがよく表現されている.(オンライン カラー)



図2 金属製中性子 CT 用 round robin 試験体を用いた元素毎のCT コントラストの相違. Pb のような重金属についても中性子を用いることでCT 再構成が可能である<sup>(15)(16)</sup>.

には断面積の違いを反映したコントラストを得ることがで き、図2のように各種金属製ロッドをCT値によって識別す ることが可能である<sup>(15)(16)</sup>.定量性を厳密に議論する場合に は単色中性子を用いて実験することが望ましいが,結晶構造 による散乱等の透過率スペクトルには多くの情報が含まれる ため十分な注意が必要である.

#### 3. 中性子を用いた物理的情報の3次元可視化

エネルギー分析型中性子イメージングは、中性子透過率の エネルギー依存性を解析することで観察対象内部の物理的性 質の空間分布を可視化する.中性子透過率のエネルギー依存 性において,低エネルギー領域(おおむね 0.1 eV 以下の熱・ 冷中性子領域)には中性子回折による透過中性子の減少を反 映した鋸刃のような構造(ブラッグエッジ)が見られ,一方, 高エネルギー領域(1 eV~数 10 keV の熱外中性子領域)には 共鳴吸収反応による鋭い中性子吸収が見られる. そのため, ブラッグエッジのプロファイルをフィッティングすること で、結晶構造、ひずみ、結晶子サイズ、選択配向に関する情 報を得ることができる(1)-(3).特に、パルス中性子を利用す ると、高いエネルギー分解能で正確な透過率スペクトルを得 ることができるため、高い精度での定量解析が可能であ る<sup>(17)</sup>.この解析を場所ごとに行い,得られたパラメータを マッピングすることで、結晶組織情報の2次元空間分布を 画像化することができる. 共鳴吸収反応は原子核種に依存す るため,吸収が起こるエネルギーと吸収の大きさ(断面積)か ら核種とその量を同定することができる. そのため, 共鳴吸 収を利用したイメージングは元素分布の定量解析に利用する ことができる. さらに、共鳴吸収は多くの場合鋭いピークで あり,その線幅は原子核の熱振動によるドップラー効果によ り変化する.そのため,吸収線幅の解析から特定元素の温度 の情報を知ることができ、高温領域に限定されるものの、構 成元素を用いた温度分布の可視化にも利用することが可能で ある<sup>(7)-(10)</sup>. これら以外にも,偏極中性子を用いたイメージ ングでは磁場可視化に応用できるが,磁場中でのスピンの挙 動は中性子速度(すなわちエネルギー)に依存するため本質的 にエネルギー依存性の解析が必須である<sup>(4)(5)</sup>. また,中性子 の干渉現象を用いた位相イメージングにおいても,干渉条件 は顕に中性子エネルギーに依存するため,これも本質的にエ ネルギーの選択が必要である<sup>(18)</sup>. つまり,中性子透過強度 から観察対象に関する物理的な情報を抽出する際には,中性 子エネルギー依存性を積極的に考慮した解析が必須であり, 解析を通じて得た物理量は定量的な取り扱いが可能である. つまり,エネルギー分析型中性子イメージングは物理的な情 報を定量化し,その空間分布を可視化する技術ということが できる.

エネルギー分析型中性子イメージングにより得られた画像 を元に3次元的な立体画像を再構成する取組みはこれまで にいくつもなされているが、今の段階では3次元画像化の 実現は限定的である<sup>(19)-(22)</sup>.これは、通常のCTの再構成で は対象とする量がスカラー量であるが、エネルギー分析型イ メージングが扱う数値のいくつかはスカラー量では無く、観 察方向や配置に依存するために観察対象を単純に回転させな がら透過スペクトルを撮像するだけでは再構成に必要な情報 が不足する、もしくは原理的に取得できない場合があるから である.次節以降に、エネルギー分析型中性子トモグラフィ に関する最近の研究例について紹介する.

#### (1) 結晶組織情報の3次元可視化

エネルギー分析型中性子イメージングで最も応用研究例が 多いのがブラッグエッジイメージングである.中性子回折・ 散乱に伴う透過率変化のエネルギー依存性を利用するもので ある.中性子透過率は回折限界の波長の前後で大きく変化す るためにスペクトルにはエッジのような構造が現れるが,回 折が起こる指数毎にエッジができるため、透過率スペクトル はギザギザの鋸の刃のような形になる.エッジが現れる中性 子波長から結晶相の情報が得られるが、エッジの高さ(透過 率の大きさ)から結晶相の体積分率を知ることができるた め、トモグラフィと組合せることで、結晶相の3次元的な 分布やその体積比率を表現することができる(図3)<sup>(23)</sup>.た だし、配向の強い試料については正確な分布が得られている ことが保証されない点は注意しなければならない.

ブラッグエッジイメージングではエッジの位置の微小なず れからひずみ量を解析することもできる.(ただし,ブラッ グエッジの生じる波長は散乱角 $\theta=90^{\circ}($ すなわち完全な後方 散乱)の条件であるため、観察しているひずみの方向につい ては注意しておく必要がある.)ブラッグエッジイメージング で観測するひずみの方向はビームの入射方向に依存するが, 束縛条件を与えることによりひずみのトモグラフィも可能で ある.豪州ニューキャッスル大学のグループは、J-PARC MLF の長期課題の制度を利用して、複数年のプロジェクト を実施し、ブラッグエッジによるひずみ量分布の評価を3 次元に拡張する技術開発を進めた.まず,C字型の形状の鉄 鋼試料に荷重を印加した状態で回転させながらブラッグエッ ジイメージングを実施し、独自に開発したアルゴリズムを用 いてひずみ分布の断層像を得た.この結果と有限要素法によ る数値解析結果, CT 再構成により得た断層像から変形量を 求めデジタル画像相関法(DIC)から導出した値を比較し、弾 性ひずみのトモグラフィが可能であることを示した(図 4)<sup>(24)</sup>. その後, 弾性ひずみから残留ひずみへと展開するた め,1軸方向に塑性変形させたリングと焼きばめ試料を用 い,トモグラフィの試験を実施した.得られた結果は豪州の 研究用原子炉 OPAL に設置された工学回折装置 KOWARI で求めたひずみ分布と比較され、両者の値はおおむね一致す ることが確認された(図5)<sup>(25)</sup>.アルゴリズムの詳細はここ



図3 エネルギー選択型中性子トモグラフィにより求めた結晶相の分布<sup>(23)</sup>. 左図(a),(b):オーステナイト相のブラッグエッジ 前後の波長でのCT 再構成像. 左図(c)~(f):(a)と(b)の比から求めた結晶相の体積分率の分布. 右図(a):引張試験試料 の再構成から得た体積分率,右図(b):ねじり試験試料の体積分率. 試料中心に沿った再構成結果のプロファイル(実線)と 回折から求めた結果(マーカー)の比較を行っている. VIR は初期状態,-max は最大負荷を印加した状態で,-med はその 中間の負荷条件での結果.(オンラインカラー)



図4 ブラッグエッジスペクトル解析による弾性ひずみのト モグラフィ結果<sup>(24)</sup>.(a):実験模式図,(b)ブラッグエ ッジ解析から求めたひずみ量の投影プロファイル(*q*= 0°および90°),(d)トモグラフィ再構成結果と有限要素 法による数値解析結果(FEA),デジタル画像相関法に より求めた結果(DIC)の比較.再構成結果はFEA, DICの結果とおおむね一致し,弾性ひずみ分布のトモ グラフィによる評価が実証された.(オンラインカラー)

では触れないが,再構成方法の開発は引き続き進められてお り、最終的には、回転軸方向に等方的な試料だけではなく, より一般化された、3次元的なひずみ分布の再構成がデモン ストレーションされている<sup>(26)</sup>.ただし、この3次元ひずみ 分布の再構成には、2軸での試料の回転が必要であるため非 常に長い測定時間を要する.これが任意の試料への展開への 大きな障壁の一つとなっている.

一方、多結晶試料の結晶粒の形状と方位の分布を解析する 3次元中性子回折(3DND)法の開発が進められている.この 技術は放射光を用いた3次元X線回折(3DXRD)<sup>(27)</sup>を中性 子に展開したものであり、J-PARC MLF の単結晶中性子構 造解析装置 SENJU<sup>(28)</sup>において、デンマーク工科大メンバー を中心としたグループにより実施されている<sup>(29)</sup>.3DXRD との大きな違いは取り扱うことができる試料の大きさや種類 であり、中性子の高い物質透過能力を最大限に活かすこと で、ミリメートルからセンチメートル程度の大きさの試料を 扱うことができるだけでなく、タングステン等の重元素を観 察対象として使用することができる.パルス中性子の飛行時 間分析と SENJU の大きな検出器バンクを利用することで非 常に広い散乱角範囲をカバーすることができ、多数の回折点 を一度に取得できる.粒子形状は、試料の下流に飛行時間分 解能を有する高空間分解能の2次元検出器を配置すること で試料透過像を取得して判別する.これは、ブラッグエッジ



図5 ブラッグエッジスペクトル解析による残留ひずみのト モグラフィ結果<sup>(25)</sup>. 圧縮により変形したリング試料 (左)と冷やしばめ試料(右)についての中性子回折結果 (KOWARI)と再構成結果(RADEN)の比較. 再構成結 果にはアーチファクトが見られるものの,ひずみの分 布は良い一致を示している.(オンラインカラー)



図6 飛行時間分析型 3DND による Fe ロッド内の結晶粒分 布の可視化結果<sup>(29)</sup>. 左の(a)~(d)は表示する粒サイズ の範囲を変えた図であり,(e)はすべての粒サイズを含 む最終的な再構成結果を示す.(e)の上部の赤色で示す 領域は,結晶粒サイズが微細で粒子形状が判別できな い粉末状の領域である.(オンラインカラー)

と同様に飛行時間に応じて回折による透過中性子強度にも変 化が起こるため,結晶粒形状を反映した透過率変化が観察さ れることを利用している.回折点と結晶粒の対応関係を調べ てグルーピングし,各結晶粒の3次元的な位置,形状,方 位を決定して,マッピングすることで,最終的な試料内の結 晶粒の分布を得る.例として,図6に直径1cmのFe円柱 についての再構成結果を示す<sup>(29)</sup>.

現在の 3DND ではビーム発散度や透過中性子用画像検出 器の空間分解能により,再構成可能な結晶粒サイズは 200 µm~数 mm と X 線に比べて大きいが,検出器性能の向上や 測定条件の最適化でより小さい結晶粒の再構成が可能にな る.また,将来的には外場の印加や変形過程の時間変化のよ うな *in-situ* 観察への応用だけでなく,磁気散乱を利用した 磁気構造分布や磁区のマッピングへの展開が期待されている.

#### (2) 磁場情報の3次元可視化

先に述べた通り,中性子はスピン磁気モーメントを有する ため磁場と直接相互作用することができる. その結果, 非一 様磁場中においては磁場勾配の大きさと方向に依存した加速 度を受けてビーム軌道が変化し、また、中性子スピンは磁場 ベクトルを軸として回転運動(Larmor 歳差運動)をする.い ずれにおいても中性子の状態の変化は磁場ベクトルと中性子 のスピン,運動状態(中性子の速度)に顕に依存するため、中 性子スピンの初期状態が既知である時に中性子ビームの軌道 変化やスピンの回転を検出することができれば、中性子が通 過した経路中の磁場に関する情報を得ることができる。<br />
つま り、中性子スピンの状態の変化を位置毎に調べることで磁場 の分布を可視化することが原理的に可能である.実際には, スピンの初期状態を規定するためにスピン偏極した中性子 (偏極中性子)を入射ビームとして利用し、観察対象を通過後 の中性子の偏極度(スピン量子化軸への射影)を解析すること でスピン状態の変化を取得するが、磁場は「強さ」と「向き」 を持つベクトル量であるため,偏極度もまた3次元に拡張 してベクトルとして取扱う必要がある<sup>(30)</sup>.そのため, J-PARC の RADEN にはパルス中性子のスピンの量子化軸を 3次元的に制御可能な3次元中性子偏極度解析装置が導入さ れている(31). この装置を用いた磁場の3次元可視化技術(3 次元偏極度解析中性子トモグラフィ(3DPNT))の開発が進め られている.この技術は磁場の強さと向きのそれぞれについ ての3次元分布を可視化するものであり、3次元偏極度解析 を試料を回転させて実施する. つまり, 各試料回転角に対す る合計18スピン条件で撮像し、その結果を用いて磁場の再 構成を行うことになる.

線で作製したソレノイドコイルであり、ここに電流を印加し て発生した磁場の3次元分布を再構成した.図から分かる ように、ソレノイドコイル内部だけでなくその周辺の磁場も 再現されており、空間磁場という境界が存在しない対象にお いても3次元分布を表現できている.再構成して得られた 磁場強度はビオ・サヴァールの法則を用いて計算した結果お よび磁場プローブを用いて計測した値とよく一致し、定量性 においても信頼性があることは特筆すべき特長である.この 再構成アルゴリズムは偏極度とスピン回転角との間の線形性 が保たれる範囲、言い換えると歳差回転角が $\pi$ (=180°)を超 えない磁場強度の範囲(Phase wrapping limit)に限定され, 1mT以下の弱磁場のみ適用可能であった.しかしながら, 偏極度の中性子波長依存性を考慮し、順投影計算と逐次近似 に基づく再構成法の開発により歳差回転角が π を超える強 度の磁場を扱うことが可能となり,再構成可能な磁場強度の 範囲の上限が緩和された<sup>(33)</sup>.

磁場の3次元分布を可視化する技術には,磁場プローブ を走査させる手法や(放射光や可視光の)偏光特性を用いた方 法などが開発されているが,いずれも万能な技術ではなく可 視化可能な対象は限定的である.ここで紹介した偏極中性子 を用いた手法も未だ開発段階の技術であり,応用例はソレノ イドコイル中の空間磁場に限定されている.しかしながら, 中性子は物質内部を進入して磁場と直接相互作用することが できるため,閉鎖空間中だけでなく磁性体や超伝導体等の物 資内部の磁場分布を可視化する可能性を持ち,これまではシ ミュレーションでしか評価できなかった磁場分布を実験的に 評価することが可能になると考えられる.

#### 4. おわりに

中性子を用いた3次元可視化技術はエネルギー選択/分 析やスピン偏極などのビーム制御技術と組合せることによ



図7 3DPNT によるソレノイドコイル内部の磁場分布の3次元可視化結果<sup>(32)</sup>. 再構成により求められた*x*, *y*, *z*の各方向の磁場 成分( $B_x$ ,  $B_y$ ,  $B_z$ )の分布((a)~(c))と図中の灰色出示した断面の $B_x$ ,  $B_y$ ,  $B_z$  成分の2次元分布((e)~(h))を示す. コイル 内部の磁場はほぼ  $B_x$  成分のみで表現されるが, コイルの端部には  $B_y$ ,  $B_z$  成分が現れることが分かる. また, コイルがわず かに xz 面内で傾いているため,  $B_z$  成分もコイル内部にも現れている. (オンラインカラー)

実験結果の例を図7に示す<sup>(32)</sup>.観察対象はアルミニウム

り、これまでのように観察対象の形状情報を非破壊で取得す るのではなく、対象内部の結晶組織の情報や磁場情報、ま た、本稿では詳しく紹介しなかったが、元素分布や温度分布 等を取り扱うことができる技術へと展開しつつある.そし て、ひずみや磁場のトモグラフィの開発においては、それら の空間分布を画像として表現するだけでなく、再構成により 求められた絶対値の妥当性についても評価され、応用例はま だ限定的であるが定量的な3次元可視化がなされた.その ため、中性子を用いたトモグラフィは、今後のさらなる技術 開発により他の技術では到達することができない対象物深部 の物理的な情報とその分布を3次元的に抽出する新しいア プローチとなる可能性を有する.

一方で、中性子ビームの強度は放射光などの他の放射線プ ローブと比較して依然として弱く、またビーム発散度が大き いことや光学的制御の難しさなどによる実験効率の低さのた め、エネルギー分析型中性子トモグラフィの実験には非常に 長い時間が必要である.そのため、中性子画像検出器や光学 素子等の要素技術の高度化と再構成手法の改良による実験効 率の改善がこの技術の利用展開には不可欠であり、これによ り一般的な試料に適用する障壁は大きく緩和され、多くの研 究に応用されるようになると考えている.

#### 文 献

- J. R. Santisteban, L. Edwards, A. Steuwerb and P. J. Withers: J. Appl. Cryst., 34(2001), 289–297.
- (2) 岩瀬謙二: Isotope News, **725**(2014), 7-11.
- (3) W. Kockelmann, G. Frei, E. H. Lehmann, P. Vontobel and J. R. Santisteban: Nucl. Instrum. Meth. A, **578**(2007), 421–434.
- (4) 篠原武尚: Isotope News, **732**(2015), 9-14.
- (5) M. Strobl, H. Heimonen, S. Schmidt, M. Sales, N. Kardjilov, A. Hilger, I. Manke, T. Shinohara and J. Valsecchi: J. Phys. D: Appl. Phys., 52(2019), 123001.
- (6) Y. Kiyanagi, H. Sato, T. Kamiyama and T. Shinohara: J. Phys.: Conference Series, 340(2012), 012010.
- (7)甲斐哲也: Isotope News, 727(2014), 16-19.
- (8) A. S. Tremsin, J. Rakovan, T. Shinohara, W. Kockelmann, A. S. Losko and S. C. Vogel: Scientific Reports, 7 (2017), 40759.
- (9) T. Kai, K. Hiroi, Y. Su, T. Shinohara, J. D. Parker, Y. Matsumoto, H. Hayashida, M. Segawa, T. Nakatani, K. Oikawa, S. Zhang and Y. Kiyanagi: Physics Procedia, 88 (2017), 306–313.
- (10) T. Kamiyama, J. Ito, H. Noda, H. Iwasa, Y. Kiyanagi and S. Ikeda: Nucl. Instrum. Meth. A, **542**(2005), 258–263.
- (11) T. Shinohara, T. Kai, K. Oikawa, T. Nakatani, M. Segawa, K. Hiroi, Y. Su, M. Ooi, M. Harada, H. Iikura, H. Hayashida, J. D. Parker, Y. Matsumoto, T. Kamiyama, H. Sato and Y. Kiyanagi: Rev. Sci. Instr., **91**(2020), 043302.
- (12) 中性子イメージングカタログ/中性子施設ハンドブック、日本アイソトープ協会 https://www.jrias.or.jp/report/cat1/218.html
- (13) Y. Matsumoto, M. Segawa, T. Kai, T. Shinohara, T. Nakatani,
  K. Oikawa, K. Hiroi, Y. Su, H. Hayashida, J. D. Parker, S. Zhang and Y. Kiyanagi: Phys. Procedia, 88(2017), 162.
- (14) F. Grazzi, C. Cialdai, M. Manetti, M. Massi, M. P. Morigi, M. Bettuzzi, R. Brancaccio, F. Albertin, T. Shinohara, T. Kai, A. Fedrigo, A. D. Giovanni, F. Arneodo, R. Torres, O. Al-Ketan, J. Elhashemi, F. Taccetti and L. Giuntini: Rend. Fis. Acc.

Lincei, **32**(2021), 463–477.

- (15) 篠原武尚,及川健一,松本吉弘:金属,アグネ技術センター, 91 (2021), 214-220.
- (16) A. P. Kaestner, et al.: Phys, Proc., 43, (2013), 128-137.
- (17) H. Sato, T. Kamiyama, K. Iwase, T. Ishigaki and Y. Kiyanagi: Nucl. Instrum. Methods A, 651 (2011), 216–220.
- (18) Y. Seki, T. Shinohara, J. D. Parker, W. Ueno, T. Samoto, W. Yashiro, A. Momose, Y. Otake and Y. Kiyanagi: Europhys. Lett., **123** (2018), 12002.
- (19) H. Sato, M. Sato, Y. H. Su, T. Shinohara and T. Kamiyama: ISIJ Int., **61**(2021), 1584–1593.
- (20) J. D. Parker, M. Harada, S. Iwaki, S. Kabuki, Y. Kishimoto, H. Kubo, S. Kurosawa, Y. Matsuoka, K. Miuchi, T. Mizumoto, H. Nishimura, T. Oku, T. Sawano, T. Shinohara, J. Suzuki, A. Takada, T. Tanimori, K. Ueno and T. Uchida: J. Phys.: Conference Series, **502**(2014), 012048.
- (21) H. Sato, T. Kamiyama and Y. Kiyanagi: Nucl. Instrum. Meth. A, **605**(2009), 36–39.
- (22) R. F. Ziesche, A. S. Tremsin, C. Huang, C. Tan, P. S. Grant, M. Storm, D. J. L. Brett, P. R. Shearing and W. Kockelmann: J. Imaging, 6(2020), 136.
- (23) R. Woracek, D. Penumadu, N. Kardjilov, A. Hilger, M. Boin, J. Banhart and I. Manke: Adv. Mater., 26 (2014), 4069–4073.
- (24) J. N. Hendriks, A. W. T. Gregg, C. M. Wensrich, A. S. Tremsin, T. Shinohara, M. Meylan, E. H. Kisi, V. Luzin and O. Kirsten: Phys. Rev. Materials, 1(2017), 053802.
- (25) A. W. T. Gregg, J. N. Hendriks, C. M. Wensrich, A. Wills, A. S. Tremsin, V. Luzin, T. Shinohara, O. Kirstein, M. H. Meylan and E. H. Kisi: Phys. Rev. Appl., **10**(2018), 064034.
- (26) J. N. Hendriks, A. W. T. Gregg, R. R. Jackson, C. M. Wensrich, A. Wills, A. S. Tremsin, T. Shinohara, V. Luzin and O. Kirsten: Phys. Rev. Mater., 3(2019), 113803.
- (27) H. F. Poulsen: J. Appl. Cryst., 45(2012), 1084-1097.
- (28) T. Ohhara, R. Kiyanagi, K. Oikawa, K. Kaneko, T. Kawasaki, I. Tamura, A. Nakao, T. Hanashima, K. Munakata, T. Moyoshi, T. Kuroda, H. Kimura, T. Sakakura, C. H. Lee, M. Takahashi, K. Ohshima, T. Kiyotani, Y. Noda and M. Arai: J. Appl. Cryst., 49 (2016), 120–127.
- (29) A. Cereser, M. Strobl, S. A. Hall, A. Steuwer, R. Kiyanagi, A. S. Tremsin, E. B. Knudsen, T. Shinohara, P. K. Willendrup, A. B. S. Fanta, S. Iyengar, P. M. Larsen, T. Hanashima, T. Moyoshi, P. M. Kadletz, P. Krooß, T. Niendorf, M. Sales, W.W. Schmahl and S. Schmidt: Scientific Reports, 7 (2017), 9561.
- (30) M. Th. Rekveldt: Z. Phys., **259**(1973), 391–410.
- (31) T. Shinohara, K. Hiroi, Y. Su, T. Kai, T. Nakatani, K. Oikawa, M. Segawa, H. Hayashida, J. D. Parker, Y. Matsumoto, S. Zhang and Y. Kiyanagi: J. Phys.: Conference Series, 862 (2017), 012025.
- M. Sales, M. Strobl, T. Shinohara, A. Tremsin, L. T. Kuhn, W.
   R. B. Lionheart, N. M. Desai, A. B. Dahl and S. Schmidt: Scientific Reports, 8(2018), 2214.
- (33) M. Sales, T. Shinohara, M. K. Sørensen, E. B. Knudsen, A. S. Tremsin, M. Strobl and S. Schmidt: J. Phys. D: Appl. Phys., 52 (2019), 205001.



NE STATE

三次元組織解析の最前線 後編

TEM/STEM トモグラフィーによる最近の研究

波多 聰\*<sub>1</sub>,\*\* 趙 一方\*\*\* 井原史朗\*\*\*\*<sub>1</sub>) 斉藤 光\*\*\*\*<sub>2</sub>) 光原昌寿\*<sub>2</sub>) 村山光宏\*\*\*\*<sub>3</sub>,\*\*\*\*\*

#### 1. はじめに

電子線トモグラフィー(Electron Tomography: ET)は透過 電子顕微鏡法(Transmission Electron Microscopy: TEM)や 走査透過電子顕微鏡法(Scanning Transmission Electron Microscopy: STEM)による三次元観察手法の一つである. 現在, ET の空間分解能は既に原子分解能に到達しており, ナノ粒子に限定されたものではあるが,非晶質物質の原子分 解能 ET 観察もいよいよ実現可能となってきている<sup>(1)</sup>. 一方 で,ここ数年,その場観察と ET を融合したその場 ET 観察 への取り組みが増加しつつある<sup>(2)</sup>.本稿では,その場 ET 観 察について最近の研究を中心に紹介する.

#### 2. その場 ET 観察の例

ET が材料系分野で最も成功している応用例はナノ材料で ある.これは,透過型の電子顕微鏡画像における投影要件 (像の強度が試料厚み,密度,濃度など三次元可視化したい 対象の単調関数となっていること)や,非弾性散乱の影響で 試料が厚くなると像がぼやけたり投影要件が破綻したりする といった物理的な制約から,自然と導かれるものと考えられ る.それでは,ET がその場観察と融合すると,ナノ材料研 究にどのような展開が考えられるだろうか.例えば,ナノ粒 子の加熱や化学反応に伴う形態変化をその場 ET 観察により 三次元可視化できれば、ナノ粒子が材料として機能している 際の表面や内部のダイナミクスを三次元的に明らかにし、機 能発現との関係を定量的に理解することに繋がると期待でき る. この方面で精力的な研究を展開しているグループとし て、原子分解能 ET を先導する米国 Miao ら<sup>(1)(3)</sup>やベルギー Bals ら<sup>(4)-(6)</sup>、環境 TEM によるオペランド型その場 TEM ET をリードするフランス Epicier ら<sup>(7)(8)</sup>(図1)が挙げられ る.

一方で、バルク材料を観察対象とした場合に最近応用例が 増えているのが結晶中の転位である.もちろんX線でも転 位の三次元可視化は可能であるが<sup>(9)</sup>、変形組織など、転位密 度が高い場合の転位線一本一本の可視化においては電子線の 方が現時点では有利なようである.そのためか、筆者らがそ の場 ET の手法開発に関する研究<sup>(10)-(12)</sup>を紹介した際には、 転位の各種ダイナミクスの三次元可視化に触れてほしいとい う要望が複数寄せられた.具体的には、応力下での析出物・ 粒界と転位の相互作用や、再結晶に伴う転位下部組織の変化 を三次元動画像として可視化することへの期待が大きい.こ うした期待が寄せられる背景として、これまで盛んに行われ てきた結晶塑性挙動のその場観察や各種理論計算だけでは十 分に解明できていない点や、更なる知見がもたらされる可能 性があるためではないかと推察している.

転位の動的挙動のその場 ET 観察としては、ステンレス鋼

<sup>\*</sup> 九州大学大学院総合理工学研究院;1)教授 2)准教授(〒816-8580 春日市春日公園 6-1)

<sup>\*\*</sup> 超顕微解析研究センター;教授

<sup>\*\*\*</sup> 九州大学大学院総合理工学府;大学院生

<sup>\*\*\*\*</sup> 九州大学先導物質化学研究所;1)助教 2)准教授 3)教授

<sup>\*\*\*\*\*</sup> バージニア工科大学工学部材料工学科;教授

Recent Studies on TEM/STEM Tomography; Satoshi Hata<sup>\*,\*\*</sup>, Yifang Zhao<sup>\*\*\*</sup>, Shiro Ihara<sup>\*\*\*\*</sup>, Hikaru Saito<sup>\*\*\*\*</sup>, Masatoshi Mitsuhara<sup>\*</sup>, Mitsuhiro Murayama<sup>\*\*\*\*,\*\*\*\*</sup>(\*Faculty of Engineering Sciences, Kyushu University, Fukuoka. <sup>\*\*</sup>The Ultramicroscopy Research Center, Kyushu University, Fukuoka. <sup>\*\*\*</sup>Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, Fukuoka. <sup>\*\*\*\*</sup>Institute for Materials Chemistry and Engineering, Kyushu University, Fukuoka. <sup>\*\*\*\*</sup>Department of Materials Science and Engineering, Virginia Tech, Blacksburg, VA, USA)

Keywords: three-dimensional (3D), in-situ, electron tomography (ET), transmission electron microscopy (TEM), scanning transmission electron microscopy (TEM)

<sup>2021</sup>年11月12日受理[doi:10.2320/materia.61.84]



図1 SiO<sub>2</sub>に包埋されたPdナノ粒子のその場ET観察<sup>(8)</sup>.
 (a)-(c)20℃で高真空下(6×10<sup>-7</sup>mbar),400℃で4mbarの水素雰囲気中60分保持後,および500℃で4mbarの水素雰囲気中60分保持後にそれぞれ撮影した連続傾斜TEM明視野像における試料傾斜角度-28°での像のみを表示.
 (d)-(f)各連続傾斜像データから再構成した三次元画像.
 (g)-(i)Pd粒子の形態を球とみなして(d)-(f)の三次元画像から求めたサイズ分布.水素雰囲気下での熱処理に伴いPdナノ粒子の平均粒径が16 nm→17 nm→19 nm と増大している.



図2 伸線加工後に熱処理を施したパーライト鋼のその場変 形 ET 観察<sup>(12)</sup>. 直径3mmのディスク状試料に電解研 磨を施した試料を使用. (a) 試料への引張応力負荷と連 続傾斜 TEM 明視野像の撮影を繰り返し, 10~14番目 の連続傾斜像データから試料傾斜角度11°のみを表示. 一点鎖線で囲んだ大小重なって見える球状化セメンタ イト粒子に,点線で示した転位がバイパス状に相互作 用している様子が見えている. (b)各連続傾斜像データ からの三次元再構成結果. セメンタイト粒子に相互作 用している転位領域(矢印)が応力負荷とともに広がっ ている.

における転位と粒界の相互作用をその場 ET 観察した米国 Kacher ら<sup>(13)</sup>,そこから数年遅れてパーライト鋼における球 状化セメンタイト粒子と相互作用する転位の動きをその場 ET 観察した筆者らによるもの(図2)<sup>(11)(12)</sup>が挙げられる. さらに、転位一本一本の形態と性質の変化の過程にまで踏み



図3 MgOにおける転位の熱処理および電子線照射下でのその 場ET観察<sup>(14)</sup>.電子線加速電圧はいずれも200 kVであ り,図中の角度は観察方向を表す. $t_0$ :熱処理および電 子線照射前の初期状態のSTEMトモグラフィー観察結果.  $t_1$ :650℃で15分間かけて3.0×10<sup>7</sup> electron/nm<sup>2</sup>の電子線 照射後. $t_2$ :650℃で45分間かけて9.0×10<sup>7</sup> electron/nm<sup>2</sup> の電子線照射後. $t_3$ :650℃で105分間かけて21.1×10<sup>7</sup> electron/nm<sup>2</sup>の電子線照射後.転位の上昇運動と交差す べりにより転位の形態が直線的な形状から,らせん的な 形状へと変化している.(オンラインカラー)

込んで三次元ダイナミクスの可視化と解析を行った報告がな されたのはごく最近である.フランス Mussi らによる MgO の加熱および電子線照射に伴うらせん形状転位の発達過程の その場 ET 観察(図 3)<sup>(14)</sup>が初期の成功例として挙げられる.

#### 3. その場 ET 観察の課題と要素技術の進展

その場 ET 観察における課題は多いが,なかでも喫緊の課 題は時間分解能の向上である.ET 観察では試料を±60~ 75°まで傾斜しながら多数の TEM/STEM 像(投影像)を収録 する必要があり,それには通常,数十分から数時間を要す る.そのため,もともと ET はその場観察から最も遠いとこ ろに位置づけられる観察手法であったと言える.その場 ET という観察手法が現実味を帯びてきたのは,連続傾斜像の収 録時間を劇的に短縮できるという認識が共有されてきた 2010年代の前半頃であり,それには次のような背景があっ た.まず,その場 TEM 観察に適用できる高速連続画像収録 が可能なカメラが商用化されたこと.続いて,直接倍率や空 間分解能の制限はあるものの, 試料傾斜を途中で止めること なく連続的に傾斜角度を変えながら同一視野の連続撮影が行 える程に試料ステージゴニオメーターの機械的動作が安定化 してきたことが挙げられる.

現在の電子顕微鏡技術において ET 観察の時間分解能を制 限しているのは試料ステージゴニオメーターの機械的動作で ある. 例えば, Thermo Fisher Scientific 社の TEM/STEM (Titan G3 Cubed, 図4)を例に挙げると、最速で毎秒約28° の試料傾斜が可能であるが、-70°から+70°まで連続傾斜す るのに約5秒かかる<sup>(11)(12)</sup>.これに対して,TEM用カメラ に関しては、例えば電子直接検出型のタイプだと毎秒1000 フレーム程度の連続撮影が可能である<sup>(15)</sup>.これらのスペッ クから,例えば1°傾斜ごとに1フレーム,試料傾斜角度 -70°から+70°まで合計141フレームを連続撮影するとして も、仮にゴニオメーターの傾斜速度に制限がなければ撮像総 時間は0.141秒程度と見積もられ、試料傾斜に要する時間に 比べると十分に短い.したがって、その場 TEM ET の最高 時間分解能は試料ステージゴニオメーターの傾斜速度で決ま り、5秒程度と言える.実際、図1に示すその場TEMET 観察での撮像時間は、三次元画像1フレームあたり6~8秒 となっている.つまり、6~8秒間に試料に変化がないこと を仮定して三次元画像1フレームを再構成していることに なる. 最近報告が増えている転位のステレオ観察による三次 元可視化の場合<sup>(16)</sup>でも、十分な空間分解能を得るには10°程 度の視差角, すなわち試料傾斜が必要となる. この場合も試 料ステージゴニオメーターの傾斜動作が律速となり、ステレ オペア画像1組の撮影に最短でも0.5秒程度の試料傾斜時間 を要することになる.このように,その場 ET 観察の材料応 用を考える場合,時間分解能の把握は重要である.現状で は,試料を加熱する過程のその場 ET 観察の多くは,連続傾 斜像の撮影は試料温度を室温に戻して行っている<sup>(2)-(5)</sup>(ただ し,図1は例外で,試料温度を高温で維持したまま撮影し ている).同様に,図2の塑性変形その場 ET 観察では連続 傾斜像撮影時は試料にかける応力を一定にしている<sup>(11)(12)</sup>. すなわち,加熱しながら,あるいは応力を変化させながらの



 図4 毎秒28°の連続試料傾斜が可能な TEM/STEM(Titan G3 Cubed)の試料ステージゴニオメーター(図中矢印).
 (オンラインカラー)



図5 異なる条件で撮影したオーステナイト鋼の転位のSTEM明視野連続傾斜像の比較<sup>(19)</sup>.撮影時の加速電圧はいずれも300 kV であり,像中の角度値は試料傾斜角度を表す.(a)試料を毎秒28°の速さで連続傾斜しながら,512×512ピクセルのSTEM像 を撮像速度70ミリ秒/フレーム(=114ナノ秒/pixel.画像スキャンに30ミリ秒/フレーム,画像保存に40ミリ秒/フレームかか り,合計70ミリ秒/フレーム)で連続撮影.連続傾斜像の総収録時間は約5秒.水平方向に沿った直線状の擬像コントラストが 顕著.(b)(a)と同じスキャン条件で撮影した類似の転位STEM画像8750枚を,深層学習型アルゴリズムU-Netに学習さ せ,その結果得られたノイズフィルターを(a)の連続傾斜像に適用したもの.線状の擬像コントラストが取り除かれ,像コン トラストが向上している.(c)(a)と同一の視野において,試料傾斜(2°)と撮像(撮像速度1.6秒/フレーム)を交互に繰り返す通 常の収録方法で得たSTEM明視野連続傾斜像.連続傾斜像の総収録時間は約30分.(オンラインカラー)


図6 図5に示した STEM 連続傾斜像からの三次元再構成結果の比較<sup>(19)</sup>. (a) 図5(b)の高速スキャン STEM 連続傾斜像からの 再構成結果. (b) 図5(c)の通常条件で収録した低速スキャン STEM 連続傾斜像からの再構成結果. (c) (a) と(b)を重ねて 表示したもの. 三次元再構成された転位の三次元像コントラストは両者でほぼ一致している. (オンラインカラー)

その場 ET 観察を行った報告は少なく、今後の課題と言える<sup>(17)</sup>.

当初,電子プローブを二次元走査して画像を取得する STEM は高速画像収録という点ではTEM に比べて不利と 考えられてきたが,その認識を修正するほどの技術革新が最 近報告されてきている<sup>(18)(19)</sup>.東大の石川らは,独自の装置 開発により STEM 撮像速度の高速化を図っている<sup>(18)</sup>.九大 の斉藤らは,電子プローブの高速スキャン時に顕著となる STEM 像中のノイズや擬像の成分を,機械学習の技術を活 用して効果的に取り除くことに成功するとともに(図5), TEM ET と同レベルの5秒で,通常観察と同レベルの像コ ントラストを有する STEM 連続傾斜像を収録可能であるこ とを示している(図6)<sup>(19)</sup>.

TEM だと色収差でぼやけてしまうような厚い試料でも STEM だとぼやけることなく観察できる<sup>(11)</sup>.高角度環状暗 視野(High-Angle Annular Dark-Field: HAADF)法を使えば 回折コントラストの影響を避けて質量厚みコントラストの連 続傾斜像が得られる<sup>(20)(21)</sup>など,ETの観察モードとして STEM は TEM より優れる点が多く、特に材料系試料にお いて STEM モードが使えることは ET の適用範囲拡大に直 結する.STEM 高速撮影技術の進歩により、その場 ET 研 究は確実に加速するものと思われる.

このように,最近の技術革新によって TEM や STEM の ET 観察に必要な連続傾斜画像データが 5 秒程度で得られる ようになった.またこれに関連して,STEM 連続傾斜像を 収録した直後にリアルタイムで三次元再構成画像が出力され る技術も開発されてきている<sup>(5)</sup>.こうした技術革新は,今後 の TEM/STEM 観察のスタイルにパラダイムシフトをもた らすことにならないだろうか.通常の観察に比べて時間がか かる,作業工程が多くて面倒,といった理由で敬遠されてき た ET に対する認識が見直されることを期待したい.

### 4. おわりに

本稿では、TEM/STEMトモグラフィー(ET)のトピック として、その場観察とET観察を融合したその場ET観察に 関する最近の研究を紹介した.電子プローブを用いるETに 限らず、コンピュータ断層撮影法(Computed Tomography: CT)とその場観察の融合、すなわちその場CTは三次元イメ ージング技術における共通課題と認識される.医療系では既 に心臓の動きが三次元動画像で可視化されている<sup>(22)</sup>他、そ の場X線CTの材料応用も進んでいる<sup>(23)</sup>.像コントラスト 形成メカニズムの違いなどから、異種プローブ間での直接の 技術移転は容易ではないかもしれないが、各種プローブを横 断するその場CT技術の進歩や横断的活用を経て、その場 ETも着実に進歩するものと予想される.

本稿で紹介した研究において,以下の皆様にご協力いただ きました.ここに御礼申し上げます. 鯉池卓,仲間陸人(九 州大学),株式会社マックスネット,株式会社システムイン フロンティア,株式会社メルビル.また,本稿で紹介した研 究は次の研究助成を受けて行われました:文部科学省および JSPS 科 学 研 究 費 補 助 金(JP18H05479, JP19H02029, JP20H02426, JP20H02479, JP20K21093),JST - CREST (JPMJCR18J4, JPMJCR1994),JST 先端計測分析技術・機 器開発プログラム,池谷科学技術振興財団.

#### 文 献

 Y. Yang, J. Zhou, F. Zhu, Y. Yuan, D. J. Chang, D. S. Kim, M. Pham, A. Rana, X. Tian, Y. Yao, S. J. Osher, A. K. Schmid, L. Hu, P. Ercius and J. Miao: Nat., **592**(2021), 60–64.

- (2) S. R. Spurgeon, C. Ophus, L. Jones, A. Petford-Long, S. V. Kalinin, M. J. Olszta, R. E. Dunin-Borkowski, N. Salmon, K. Hattar, W.-C. D. Yang, R. Sharma, Y. Du, A. Chiaramonti, H. Zheng, E. C. Buck, L. Kovarik, R. L. Penn, D. Li, X. Zhang, M. Murayama and M. L. Taheri: Nat. Mater., **20**(2021), 274–279.
- (3) J. Zhou, Y. Yang, Y. Yang, D. S. Kim, A. Yuan, X. Tian, C. Ophus, F. Sun, A. K. Schmid, M. Nathanson, H. Heinz, Q. An, H. Zeng, P. Ercius and J. Miao: Nat., 570(2019), 500–503.
- (4) H. Vanrompay, E. Bladt, W. Albrecht, A. Báché, M. Zakhozheva, A. Sánchez-Iglesias, L.M. Liz-Marzán and S. Bals: Nanoscale, 10(2018), 22792–22801.
- (5) A. Skorikov, W. Albrecht, E. Bladt, X. Xie, J. E. S. van der Hoevem, A. van Blaaderenm, S. Van Aert and S. Bals: ACS Nano, 13(2019), 13421–13429.
- (6) H. Vanrompay, J.-W. Buurlage, D. M. Pelt, V. Kumar, X. Zhuo, L. M. Liz-Marzán, S. Bals and K. J. Batenburg: Part. Part. Syst. Char., 37 (2020), 2000073.
- (7) L. Roiban, S. Li, M. Aouine, A. Tuel, D. Farrusseng and T. Epicier: J. Microsc., 269 (2018), 117–126.
- (8) S. Koneti, L. Roiban, F. Dalmas, C. Langlois, A.-S. Gay, A. Cabiac, T. Grenier, H. Banjak, V. Maxim and T. Epicier: Mater. Charact., 151(2019), 480–495.
- (9) H. Simons, A. C. Jakobsen, S. R. Ahl, C. Detlefs and H. F. Poulsen: MRS Bulletin, 41(2016), 454–459.
- (10) S. Hata, S. Miyazaki, T. Gondo, K. Kawamoto, N. Horii, K. Sato, H. Furukawa, H. Kudo, H. Miyazaki and M. Murayama: Microsc., 66 (2017), 143–153.
- (11) S. Hata, H. Furukawa, T. Gondo, D. Hirakami, N. Horii, K. Ikeda, K. Kawamoto, K. Kimura, S. Matsumura, M. Mitsuhara, H. Miyazaki, S. Miyazaki, M. Murayama, H. Nakashima, H. Saito, M. Sakamoto and S. Yamasaki: Microsc., **69**(2020), 141–155.
- (12) S. Hata, T. Honda, H. Saito, M. Mitsuhara, T. C. Petersen and M. Murayama: Curr. Opin. Solid State Mater. Sci., 24(2020), 100850.
- (13) J. Kacher and I. M. Robertson: Acta Mater., 60(2012), 6657– 6672.
- (14) A. Mussi, P. Carrez, K. Gouriet, B. Hue and P. Cordier: Comptes Rendus. Physique, **22**(S3) (2021), 1–15 (doi: 10.5802/crphys.80).
- (15) V. Migunov, H. Ryll, X. Zhuge, M. Simson, L. Strüder, K. J. Batenburg, L. Houben and R. E. Dunin-Borkowski: Sci. Rep., 5 (2015), 14516.
- (16) L.A. Jácome, K. Pöthkow, O. Paetsch and H.-C. Hege: Ultramicrosc., **195** (2018), 157–170.

- (17) W. Albrecht and S. Bals: J. Phys. Chem C, **124**(2020), 27276– 27286.
- (18) R. Ishikawa, Y. Jimbo, M. Terao, M. Nishikawa, Y. Ueno, S. Morishita, M. Mukai, N. Shibata and Y. Ikuhara: Microsc., 69 (2020), 240–247.
- (19) Y. Zhao, S. Koike, R. Nakama, S. Ihara, M. Mitsuhara, M. Murayama, S. Hata and H. Saito: Sci. Rep., 11(2021), 20720
- (20) M. Koguchi, H. Kakibayashi, R. Tsuneta, M. Yamaoka, T. Niino, N. Tanaka, K. Kase and M. Iwaki: J. Electron Microsc., 50(2001), 235–241.
- (21) M. Wayland, P. A. Midgley and J. M. Thomas: Chem. Commun., 10(2001), 907–908.
- (22) https://www.youtube.com/watch?v=-bOFRHgCOV0
- (23) W. Yashiro, W. Voegeli and H. Kudo: Appl. Sci., 11(2021), 8868.

#### **★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★** 波多 聰

- 1994年 九州大学大学院総合理工学研究科修士課程修了
- 1994年 九州大学大学院総合理工学研究科助手
- 2007年 九州大学大学院総合理工学研究院准教授
- 2015年- 現職
- 専門分野:電子顕微鏡,金属ナノ組織,規則-不規則変態
- ◎透過型電子顕微鏡による構造材料や超伝導材料の微細構造解析に従事.最近は、電子線トモグラフィーやナノ領域結晶方位マッピングの応用を中心に活動.

<sup>\*\*\*\*\*\*</sup> 





趙 一方

井原史朗

村山光宏



斉藤



光原昌寿

光



# 1. はじめに

便利な日常の生活を支える工業製品の多くは電子制御され た電化製品が担っている. これらの製品は持続可能な社会を 目指す点からも高速化と省電力化が望まれている. 電子デバ イスの小型化と省電力化には半導体素子のピッチを小さくす ることで達成されてきたが、現在はそれに加え半導体素子を 三次元的に配置することにより更に集積化した CPU やメモ リーなどの電子デバイスが開発されている<sup>(1)(2)</sup>.従ってこれ らの電子デバイス解析には透過電子顕微鏡(Transmission Electron Microscope: TEM)による二次元の TEM 像の観察 では十分ではなく、三次元の構造解析手法が必要になってい る. 電子線トモグラフィー(Electron Tomography: ET)は TEM と計算機トモグラフィー(Computerized Tomography: CT)を組み合わせた三次元微細構造解析を行う手法である. この方法では試料ステージを傾斜させながら TEM 像もしく は STEM 像を連続的に撮影し,得られた画像の連続傾斜シ リーズを逆投影することで三次元構造を再構成することがで きる<sup>(3)</sup>. TEM/STEM トモグラフィーによって得られた三 次元再構成像の分解能はサブナノスケールに達しており、半 導体の三次元微細構造解析に適用されている<sup>(4)(5)</sup>. さらに近 年では ET とエネルギー分散型 X 線分光法(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy: EDS) を組み合わせて三次元の元 素マップを得るEDSトモグラフィーが試みられてい る<sup>(6)-(9)</sup>.本報告では EDS トモグラフィーの詳細とその応用 例を示すとともに EDS トモグラフィーが抱える課題につい て報告するものである.

#### 2. EDS トモグラフィーの概要

EDSトモグラフィーは,TEM内に挿入された試料に対して試料を傾斜しながら元素マップを取得し,得られた二次

元の元素マップの連続傾斜シリーズに対してコンピューター を用いて再構成の計算をすることにより三次元の元素マップ を得る手法である<sup>(10)(11)</sup>. EDS トモグラフィーは2000年代 には既に報告されていたが、当時は Si(Li)検出器が使われ ており、検出器の大きさが限られていたため、検出感度が低 くかつ信号処理速度も遅いため, EDS マップの連続傾斜シ リーズを撮影するために長時間電子線を試料に照射する必要 があった. そのため, 電子線ダメージやコンタミネーション の影響が深刻で対象となる試料は限られていた.しかし近 年,シリコンドリフト検出器(Silicon Drift Detector: SDD) が開発され信号処理速度が大幅に向上し、大面積の検出器も 作製可能になったこと、また TEM 内に複数の EDS 検出器 を導入することが可能になったことにより、Si(Li)検出器が 使われていた時代に比べ現在は検出立体角が13~16倍ほど になり、高速に EDS マップが取得できるようになっ た<sup>(12)(13)</sup>. これにより金属や半導体材料などについて EDS トモグラフィーによる三次元元素マップを取得することが盛 んに行われるようになってきた. しかしながら電子線照射に 弱い生体試料やソフトマテリアルは依然として EDS トモグ ラフィーによる解析を適用することは難しい状況にある.

#### 3. EDS トモグラフィーの取得方法

EDSトモグラフィーによる三次元元素マップを得るまで には三つの工程を経なければならない.最初の工程は二次元 の元素マップの連続傾斜シリーズを得ることである.高傾斜 試料ホルダーに固定された試料を TEM 内に搬送し,試料ス テージを傾斜させながら EDS マップを取得する.このとき 傾斜角度( $\theta$ )の範囲は±60度~±80度に制限される.本来な ら±90度が望ましいのだが,薄膜に加工された通常の TEM 試料の場合,高角( $\theta$ )に試料ステージを傾斜すると試料厚み は $1/\cos(\theta)$ 倍に厚くなり, TEM/STEM 像も EDS マップ も取得ができない.この取得できない角度範囲は高角側に存

<sup>\*</sup> 日本電子株式会社 EM 事業ユニット EM アプリケーショングループ;副主査(〒196-0021 東京都昭島市武蔵野 3-1-2) The Three Dimensional Elemental Analysis by Using EDS Tomography; Yoshitaka Aoyama\*(\*JEOL Ltd., Tokyo) Keywords: *electron tomography, EDS(energy dispersive X-ray spectroscopy*) 2021年10月12日受理[doi:10.2320/materia.61.89]

在し楔型になるのでミッシングウェッジと呼ばれており,三次元再構成像に虚像を発生させる原因となる.電子線トモグラフィーでは、ミッシングウェッジを可能な限り小さくするために、高傾斜できる視野を選択することが重要である<sup>(14)</sup>.二次元の元素マップの連続傾斜シリーズの撮影は、トモグラフィー用自動取得ソフトウェアとEDSアナライザーソフトウェアを連携させることにより自動化されている. 図1は塗膜試料にEDSトモグラフィーを適用して自動で取得したEDSマップの連続傾斜シリーズの抜粋である.実際には傾斜角度範囲±60度、角度ステップ4度で取得しており、31枚のEDSマップの傾斜シリーズが元素種ごとに生成されたデータセットになっている.

二番目の工程は連続傾斜シリーズに対して位置合わせと三次元再構成の計算を行うことである.連続傾斜シリーズの取 得時に三次元再構成したい対象物が常に画像の中心に来るよ うにレンズの偏向コイルを使って自動で位置合わせしてくれ るが,この位置合わせ精度は高い分解能の三次元再構成像を 得るためには十分でない.取得した連続傾斜シリーズに対し て更に高精度の位置合わせを計算で行った後に三次元再構成 の計算にかけることが一般的に行われている.EDSトモグ ラフィーの場合は,図1のようにSTEM像と元素種ごとの 連続傾斜シリーズが複数出力されるので,バッチ処理によっ てすべての元素種の連続傾斜シリーズに対し,位置合わせを 同一の条件で行い,一括で三次元再構成される.

|       | ·60度 | -48度   | ·36度 | -24度 | ·12度 | 0度 | 12度 | 24度 | 36度 | 48度 | 60度 |
|-------|------|--|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| STEM像 | 12   | 12   | 14   | Y#   | Y.   | 14 | 14  | 14  | N.  | 14- | 14. |
| Ti    | -    | - 14<br>14 -   |      | 1    | 1.44 | 1  | 1   | 1   | 14  | 14  | 14  |
| Al    | 100  | and the second s | 12   |      |      |    | 1   | 12  | 1   |     |     |
| Fe    | - 5  |  | 1    | . \$ |      |    |     |     |     |     |     |
| Si    |      |  |      |      |      |    |     |     |     |     |     |

図1 傾斜角度範囲は±60度,角度ステップは4度で撮影し た塗膜試料の EDS マップの連続傾斜シリーズを12度ご とに抜粋した.スケールバーの長さは1µm に対応して いる.(オンラインカラー)



 図 2 塗膜試料の三次元元素マップ. (a) Tiマップ, (b) Al マップ, (c) Feマップ, (d) Siマップ, (e) 重ね合わせ (Ti, Al, Fe, Si). (オンラインカラー)

三番目の工程は,再構成された元素種ごとの三次元データ を三次元可視化ソフトウェアで重ね合わせて表示することで ある.図2(a)-(d)は塗膜試料の三次元元素マップであり, それぞれチタン・アルミニウム・鉄・シリカの分布を示して いる.それぞれの三次元元素マップのボリュームデータを重 ね合わせて表示することで元素の分布が明瞭に理解できるよ うになる(図2(e)).

#### 4. EDS トモグラフィーの適用例:半導体試料

三次元構造を持つ代表的なトライゲートの半導体 FinFET に EDS トモグラフィーを適用したアプリケーションを紹介 する. FinFET はフィン状のシリコンチャンネルの上方と両 側面の三面をゲートで囲った構造になっており、より細いチ ャンネルを実現できる構造であり、実用化されている多くの 半導体素子に適用されている.

試料の加工は、まずウェハーをダイヤモンドカッターで小 片に加工し、機械研磨で薄片化した後、アルゴンイオンスパ ッタ装置を用いて薄膜に加工し TEM 試料とした<sup>(15)</sup>. EDS マップの連続傾斜シリーズの取得は数時間かかるので電子線 照射による試料表面のコンタミネーションの付着を防止する ために、事前にグロー放電により試料表面をクリーニングし ている.また位置合わせ用のマーカーとして金コロイドナノ 粒子を試料上に散布している. 用いた装置は冷陰極電界放出 型電子銃と球面収差補正装置,二つの大面積 SDD (158) mm<sup>2</sup>)を装備した加速電 E 300 kVのTEM (JEM -ARM300F, JEOL Ltd.) である. SDD の立体角はそれぞれ 1.106 sr, 1.108 sr であり十分に早く取得できるシステムが構 築されている<sup>(13)</sup>. 試料ホルダーは EDS トモグラフィー用に 開発した高傾斜分析ホルダーを用いており、±70度以上の 高傾斜が可能でありながら先端が細く薄く設計されており試 料から発生した X 線を効率よく検出可能な構造をしている. FinFET を断面方向から観察した HAADF 像が図3(a)であ る. HAADF 像中の白色の粒子は連続傾斜シリーズの位置 合わせ用に散布した5nmφの金コロイドナノ粒子である.



図3 FinFET 試料の HAADF 像 (a) とその三次元元素マッ プ (b)-(h). (b) Ge マップ, (c) Ti マップ, (d) Wマ ップ, (e) Oマップ, (f) Nマップ, (g) Si マップ, (h) 三次元元素マップの重ね合わせ(Ge, Ti, W, O, N, Si). (オンラインカラー)

特 集



図4 FinFET 試料の三次元元素マップ. Si 基板の面に対して垂直な Z 方向から観察した再構成断面を (a') および (b') とする.
 (a') および (b') 中の黄色の直線で切り取った断面を観察した三次元元素マップをそれぞれ (a), (b) とする. (オンラインカラー)

この視野において傾斜角度範囲±64度,角度ステップ4 度,計33枚の EDS マップの連続傾斜シリーズを取得した. 総取得時間は120分掛かった.得られた EDS マップの連続 傾斜シリーズを三次元再構成した三次元元素マップが図3 (b)-(h)である. 絶縁膜である N は軽元素のため SN 比が低 いが,GeやTi,Wのマップは高いSN比を示しており,構 造を明確に捉えることができている.図4には図3(h)で示 した FinFET の三次元元素マップをいくつかの方向から切 り出した断面を示す.図4(a)はチャンネルに垂直なY-cut 断面で,カットした位置は図4(a')のZ-cut 断面の黄線で示 してあるようにSi/Geストレッサーのある場所である.Si/ Ge ストレッサーとはチャンネルを格子定数の大きな Si/Ge 混晶で挟んで、シリコンのチャンネルを圧縮し歪ませること でチャンネルのキャリアー(この場合 PMOS なのでホール) の移動度を向上させる構造である(移動度が向上するとスイ ッチング速度と消費電力が軽減されるので、現在では殆どの 半導体素子でこの構造が適用されている). 青色で示された シリコンのフィン状のチャンネルを黄色で示された Si/Ge ストレッサーが挟んで覆っている様子が捉えられている.図 4(b)はチャンネルのほぼ中央の断面である. チャンネルと ゲート電極とその間の窒化膜、酸化膜の元素分布が確認され る.

#### 5. EDS トモグラフィーの課題

EDS トモグラフィーは三次元の元素分布像を得る手法として非常に有効な手法であるが、二つの大きな問題を抱えている. それを模式的に表したのが図5である. 球形の試料に対して電子線を走査した場合、EDS 検出器に近い側で発生

ま て り あ 第61巻 第2号(2022) Materia Japan する X 線は遮る物体がないため、そのまま EDS 検出器に到 達するが、EDS 検出器から遠い側に電子線を照射したとき に発生する X 線は試料自身の中を透過するため、試料自身 によって吸収されてしまう(図5(a)). これにより、試料に 含まれる元素の濃度と試料厚みが同じでも、EDS 検出器か ら遠い領域からの X 線カウントは近い側より低下すること になり、逆投影の理論からはずれてしまうので、三次元再構 成像に虚像を形成する原因となる<sup>(16)(17)</sup>. もう一つの EDS トモグラフィーをする上で注意しなければならないことは、 試料ホルダーや試料グリッドによる遮蔽の効果である(図5 (b)). ゴニオステージを傾斜させながら EDS マップを取得 していくので、特定の傾斜角度のときに EDS 検出器が試料 ホルダーや試料グリッドの陰になってしまい、発生した特性 X 線が遮蔽されることになる. この遮蔽の効果も三次元再



 図5 EDSトモグラフィーにおける虚像を作り出す原因を示 す模式図.(a)入射電子線によって発生した特性X線 はSDDに到達する前に試料自身に吸収されてしまう.
 (b)X軸傾斜時に試料とSDDの間に試料ホルダーが入り、特性X線を遮ってしまう.(オンラインカラー)



図6 (a) 直交配置型 EDS システムの模式図. 傾斜軸の右側に SDD1, 傾斜軸上に SDD2 がそれぞれ直交して配置されている. (b) 直交配置型 EDS システムでチタン粒子の元素マップを取得したときの X 線検出効率の角度依存性. SDD1 は-20度付近で X 線量が大きく落ち込んでいるのに対し, SDD2 はどの角度でも比較的均一な X 線量になっており,遮蔽の効果の影響が少ない.(オンラインカラー)

構成像に虚像を形成する原因となるが,撮影方法や試料の形 状を最適化することで大幅に低減することが可能である. EDS 検出器が試料ホルダーの右側と軸上に配置された直交 配置型 EDS システム(図 6(a))の TEM を用いて酸化チタン の粒子のX線カウントを傾斜角度を変えて測定した結果が 図 6(b)である. 試料ホルダーの右側に配置した EDS 検出器 (SDD1)は-20度付近に傾斜したときに図2(b)のように試 料ホルダーが陰になり、X線カウントが低下している. 一 方, 傾斜軸上に配置した EDS 検出器 (SDD2) は±60度の範 囲でほぼ一定のX線カウントを示している. つまり直交配 置型 EDS システムの場合は傾斜軸上に配置された EDS 検 出器(SDD2)のみを用いることによって遮蔽の効果を低減で きる(図7(a)). また EDS 検出器が試料ホルダーに対して左 右両側に配置された対向配置型 EDS システム(図7(b))の場 合は、プラス側(右側)に傾斜したときは右側の EDS 検出器 (SDD1)のみを、マイナス側(左側)に傾斜したときは左側の EDS 検出器(SDD2)のみを使用することにより遮蔽の効果を



図7 EDS 検出器が直交して配置されている場合,傾斜軸上 に配置された SDD2 のみを使用することで遮蔽の効果 は除去できる (a). 一方,対向に配置されている場合 は,右に傾けたときは右の SDD1 を,左に傾けたとき は左の SDD2 を使用することで遮蔽の効果を除去でき る (b).(オンラインカラー)



図8 棒状に加工された半導体試料の EDS トモグラフィーの適用例. アトムプローブホルダー (a) の先端に試料ブロックを設置 し, FIB で棒状に加工することで棒状試料を作製する (b), (c). 棒状に加工された NAND フラッシュメモリーの HAADF 像 (d) で示された領域に対して EDS トモグラフィーを適用し三次元元素マップを取得した. 三次元元素マップ (e) は電子 線入射方向である Z 方向, (f) は Y 方向からそれぞれ観察している. ミッシングウェッジのない三次元元素マップが得ら れている. (オンラインカラー)

低減できる.また,イオンビーム試料作製装置(Focused Ion Beam: FIB)で棒状に試料を加工することができれば遮 蔽の効果は大幅に低減させることができる.図8は棒状に加 工した半導体試料に EDSトモグラフィーを適用した例であ る.棒状試料専用の試料ホルダー(図8(a))の先端に NAND フラッシュメモリーの試料ブロックを設置し,FIBで加工 して得られた棒状試料が図8(b)-(c)である.この試料を TEM に搬送して±90度の傾斜角度範囲で EDS マップの連 続傾斜シリーズを撮影し得られた三次元元素マップが図8 (e)-(f)である.図8(e)は電子線入射方向であるZ方向,図 8(f)はY方向から観察している.傾斜角度制限がないため ミッシングウェッジによる三次元再構成像に虚像がなく,遮 蔽の効果も低減された高品質の三次元元素マップが得られて いることがわかる.棒状に試料を加工することは EDSトモ グラフィーでは非常に有効である.

#### 6. ま と め

EDS トモグラフィーは非破壊でナノスケールの三次元元 素マップを得る有効な手法であり、半導体の三次元構造解析 に適用されている. EDS トモグラフィーはデータ取得時に 試料ステージを傾斜するので、試料から発生する X 線がグ リッドバーや試料ホルダーに遮蔽されてしまう場合がある. これは三次元元素マップに虚像を生む原因となる.使用する EDS 検出器や試料形状を最適化することで遮蔽の効果は低 減することは可能である.試料自身によって X 線が吸収さ れる効果は同様に虚像を生む原因となる.

# 文 献

(1) D. Hisamoto, W. C. Lee, J. Kedzierski, E. Anderson, H. Takeuchi, K. Asano, T. J. King, J. Bokor and C. Hu: IEDM Tech. Dig., (1998), 1032–1034.

- (2) H. Tanaka, M. Kido, K. Yahashi, M. Oomura, R. Katsumata, M. Kito, Y. Fukuzumi, M. Sato, Y. Nagata and Y. Matsuoka: Proceedings of the Symposium on VLSI Technology, (2007), 12–14.
- (3) A. M. Cormack: J. Appl. Phys., 35(1964), 2908–2913.
- (4) M. Hayashida, L. Gunawan, M. Malac, C. Pawlowicz and M. Couillard: Microsc. Microanal., 21 (2015), 1609–1610.
- (5) B. Fu, M. Gribelyuk, L. Dumas, C. Fang, N. LaManque, L. Hodgkins and E. Chen: Microsc. Microanal., 22(2016), 326– 327.
- (6) K. Lepinay, F. Lorut, R. Pantel and T. Epicier: Micron, 47 (2013), 43–49.
- (7) P. Burdet, J. Vannod, A. Hessler-Wyser, M. Rappaz and M. Cantoni: Acta Mater., 61(2013), 3090–3098.
- (8) A. Genc, L. Kovarik, M. Gu, H. Cheng, P. Plachinda, L. Pullan, B. Freitag and C. Wang: Ultramicroscopy, 131 (2013), 24–32.
- (9) B. Goris, L. Polavarapu, S. Bals, G. Van Tendeloo and L. Liz-Marzan: Nano Lett., 14(2014), 3220–3226.
- (10) G. Möbus, R. Doole and B. Inkson: Ultramicroscopy, 96 (2003), 433–451.
- (11) Z. Saghi, X. Xu, Y. Peng, B. Inkson and G. Mobus: Appl. Phys. Lett., 91 (2007), 251906.
- (12) L. Strueder, P. Lechner and P. Leutenegger: Naturwissenschaften, 85(1998), 539–543.
- (13) I. Ohnishi, K. Miyatake, Y. Jimbo, Y. Iwasawa, M. Morita, T. Sasaki, H. Sawada and E. Okunishi: Proceedings of Microscopy & Microanalysis 2016, 22 (2016), 318–319.
- $(14)\;$  A. Yasuhara: JEOL News,  $\mathbf{40}(2005),\,46\text{--}49.$
- (15) C. S. M. Yeoh, D. Rossouw, Z. Saghi, P. Burdet, R. K. Leary and P. A. Midgley: Microsc. Microanal., 21(2015), 759–764.
- (16) Pierre Burdet, Z. Saghi, A. N. Filippin, A. Borrás and P. A. Midgley: Ultramicroscopy, 160(2016), 118–129.



青山佳敬



#### 1. 結晶方位解析と材料組織

多くの金属材料には特徴的な組織が内包され,それらは力 学特性や物性などに影響を与えている.また,これらの組織 の多くは結晶学的な特徴を持っており,その特徴が各種物性 に影響を与えることが知られている.そのため,金属組織の 観察や評価について多くの報告があり,組織の結晶学的解析 についても多くの研究がある.

このように金属組織について多くの観察および解析が行わ れているが、その多くは研磨表面での二次元観察である.実 際の金属組織は三次元的に存在しているので、連続切削観察 法による観察や形態計量学的な解析など二次元観察からの三 次元組織の類推が行われている.しかし、力学特性を検討す る上で必要となる結晶方位を含めた三次元観察および解析は 多くない.

2000年以降は電子線による結晶方位解析技術の進歩や微細加工技術の発達により,結晶方位情報を含めた詳細な三次 元像の取得が求まられるようになってきた.本稿では,三次 元組織と結晶方位解析を組み合わせた解析手法について解説 すると共にその留意点について説明する.

#### 2. 結晶方位解析を併用した界面の三次元解析

結晶方位解析を用いた三次元解析は古くから行われている.特に試料表面において観察される界面のトレースを複数 観察面から撮影し,それらのトレースから界面を特定する解 析は現在でもよく使われている<sup>(1)</sup>.多くの書籍で解析手法が 掲載されている<sup>(2)(3)</sup>ので,ここでは簡単に概略を説明する. 図1は観察対象の直方体試料を示しており,それぞれ直交す る辺の方向を X, Y, Z とした座標を定義する. この試料の座 標は正規直交系の右手系としている(以降,試料座標系).単 純化するためこの試料を既に結晶方位が分かっている単結晶 試料と考える. 試料内部には平滑な界面が含まれており,そ の界面は試料表面でトレース線として観察される. 図中では トレース線を黒太線で示している. 図中の X-Y 平面および Y-Z 平面内のトレース線の方向 r<sub>1</sub> および r<sub>2</sub> は, X および Z 方向からの観察から決定することが出来る. また,試料の結 晶方位は既に分かっているので試料座標系から結晶の座標系 (以降,結晶座標系)への変換により r<sub>1</sub> と r<sub>2</sub> を結晶座標系で 表すことが出来る. トレース線は対象の平面内に存在するの で, この平面の法線は r<sub>1</sub> と r<sub>2</sub> の外積方向となる.

この手法は非常に手軽であるが、複数方向からトレース線 を観察する必要があるため、1 mm 以下の組織を観察するの は難しい.しかし、近年は集束イオンビーム加工(以降, FIB)の技術が発達したため微細領域での二面トレース解析 が可能となった.多くの解析例があるが、ここでは Fe-0.5C 2Mn 合金の旧オーステナイト粒界の解析例を示す.図2(a) は焼入れた Fe-0.5C-2Mn 合金の走査イオン像(以降, SIM) で、旧オーステナイト粒界を白破線で示している.この粒界 のトレースに対して垂直に FIB を用い加工する.加工後の



<sup>\*</sup> 島根大学次世代たたら協創センター; 教授(〒690-8504 松江市西川津町1060)

\*\* 島根大学総合科学研究支援センター;助教

The Focal Point of Crystallography for Three Dimensional Microstructure Analysis; Shigekazu Morito and Taisuke Hayashi (\*Next Generation Tatara Co–Creation Centre, Shimane University, Matsue. \*\*Interdisciplinary Center for Science Research, Shimane University, Matsue)

Keywords: crystallography, three dimensional observation, microstructure, serial-sectioning method, electron backscatter diffraction analysis, focused ion beam milling, 3D EBSD, 3D reconstruction  $2021 \pm 10 \pm 12 \pm \text{Em}[\text{Agi}:10, 2220]$  (metoric 61.04]

SIM 像が(b)であり,さらに試料を傾斜して撮影した SIM 像が(c)である.この観察領域に対して前もって後方散乱電 子回折(以降 EBSD)測定を行い結晶方位を求めており,そ のデータを合わせて二面解析法から旧オーステナイト粒界を 決定することが出来る.

もう一つは切削観察法による面解析で、観察面上の平面の トレース線が観察面の切削後にずれる量を元に計算する手法 である. 図3にその概略を示す. 図3でも図1と同じよう に直方体の単結晶試料を示し同じ座標系をとっている. 図3 では図1のZ方向から試料を見ていることになる. X-Y平 面内にはトレース線(図中では黒線)が観察されている. この トレース線内の任意の点を点O'とする. このX-Y平面を Δz だけ X-Y平面と平行に切削する. 切削後の平面上で観 察されるトレース線を破線で示す. 切削前の点O'と同じX-Y座標にある切削後の位置を点Oと置き,切削後の平面上



図2 FIBを用いた二面解析の例:(a)加工前試料のSIM 像,(b)FIB 加工後のSIM 像と(c)傾斜後のSIM 像. 使用した試料は Fe-0.5C-2Mn 合金焼入材.

で点Oからトレース線までのX方向への距離 $\Delta x$ とY方向 への距離 $\Delta y$ を測定する.これらのトレース線が示す面の法 線は試料座標系で $[1/\Delta x, 1/\Delta y, 1/\Delta z]$ となる.このベクト ルを結晶座標系に変換すると面法線が得られる.

この手法は平行研磨さえ出来れば実施しやすい反面,切削 量を正しく把握する必要があること,測定精度が観察対象と 観察面との角度に依存すること,切削前後の像を正しく合わ せないと精度が出ないことが問題となる.近年では精密加工 の精度が上がり,マクロでは全自動連続切削観察装 置<sup>(4)-(6)</sup>,微小領域ではFIB<sup>(7)</sup>を利用する事により,この手 法を容易に実施する事が出来る.ただ,これらの機器が使用 できるのなら組織の三次元観察を行い,三次元像から界面を 解析した方が早い.三次元像を用いた解析については次の章 で述べる.

これらの手法は対象となる結晶の結晶方位を知る必要があ り、古くは結晶の形態や焼鈍双晶<sup>(8)(9)</sup>、マイクロラウエ写真 などのX線回折(10),最近ではEBSD測定(11)などでの測定 が行われる.具体的な結晶方位の測定方法は専門のテキスト において詳しく説明されているので、ここでは界面解析の時 の留意点について記述する. 最も注意するべき点は観察する ときと結晶方位を測定するときの試料座標系の違いである. 一般的にトレース線を観察するときの試料座標系と結晶方位 を測定するときの試料座標系は等しくない. 例としては SEM 内での試料座標と EBSD での試料座標の取り方の違い が挙げられる.これは観察するときの座標系では顕微鏡やカ メラ、結晶方位を決めるときの座標系ではディテクタなどか ら見た座標でとることが多く、互いの関係を考慮されていな いことが多いためである. どちらかの試料座標系を基準とし て試料座標系を統一させれば間違いはない. ただ, 座標変換 時の演算ミスや座標系の取り違いなどの解析ミスを防ぐため に焼鈍双晶など既知の界面で解析の確認を行うことが必要と 考える.

もう一つ気にしなければならないのが晶系である. 試料座 標系は一般的に正規直交系であるが,結晶の場合は立方晶以 外は正規直交系でとられていない. そのため,結晶座標系と 試料座標系を変換するときの演算にミスが起きやすく注意が 必要となる.また,対称性も異なり面法線と方向を明確に分 ける必要もあるので,解析時に極点図などで確認をとるなど 注意が必要である.近年結晶方位解析で利用される EBSD 解析の場合,専用の解析ソフトウェアを用いた解析が行わ れ,それらのソフトウェアでは各種晶系に対応している.し かし,そのソフトウェアの解析結果を無批判に受け入れるの



図3 切削型界面解析法の原理.

は危険である.

# 結晶方位解析データを併用した顕微鏡像による三 次元組織構築と解析

前章で切削による界面解析手法を紹介したが、界面だけで はなく組織に対しても連続切削による観察が行われてい る(12)(13).近年では局所結晶方位解析を併用することでより 結晶学的に組織の抽出を行うことが出来るようになった. そ の例を図4に示す(14).図4は極低炭素鋼ラスマルテンサイ トの観察例で,研磨と腐食を施し光学顕微鏡観察を行うこと を繰り返した像を元の画像として用いている.図4(a)と(b) はそれぞれ切削開始面から194 µm と399 µm 切削した面で の光顕像である. ラスマルテンサイトの場合, 光学顕微鏡像 だけでは組織の識別は難しいので,数回に1回の割合で光 学顕微鏡像組織と対応する EBSD 測定を行い旧オーステナ イト粒界,パケット,ブロックなどの組織を特定している. この解析では光学顕微鏡像の回転や水平移動をビッカース硬 さ計で付けた圧痕を画像積層時の位置合わせマーカーとして 使い,各組織境界を抽出し三次元像として再構築している. 再構築した三次元像の例として(c)と(d)に旧オーステナイ ト粒界と焼鈍双晶を示す.

光学顕微鏡を用いた切削型三次元解析は研磨機さえあれば 行うことが出来る上,比較的広範囲の組織を観察することが 出来る.ただ,この手法にはいくつか問題点があり,その中 でも切削深さの正確な測定,顕微鏡像の位置合わせの印,写 真ごとに異なる組織のコントラストが問題になる.最初の二 つの項目は最近の全自動連続切削観察装置などを使えば問題 ではなくなるが,手動でこの二項目に対応する場合,多くの 場合はビッカース硬さ計などで付けられた圧痕を使い対処す



図4 光学顕微鏡像を用いた三次元組織観察例:観察開始位 置から(a)194と(b)399 µm 切削した面での光学顕微鏡 写真,(c)と(d)は旧オーステナイト粒界(緑色,印刷版 では灰色)と焼鈍双晶界面(黄色,印刷版では薄い灰色) の三次元組織でそれぞれ視点が異なっている.(オンライ ンカラー)

ることになる. 圧痕はマーカーとしてだけでなく,そのサイ ズから試料表面から圧痕の底までの距離を測定でき,圧痕の サイズ差から切削深さを求めることが出来る.ただ,圧痕は 切削を続けると消えるので常に圧痕を打ち続ける必要があ る.また,材料のスプリングバックがあるために圧子形状か ら圧痕サイズと深さの関係を予測することが出来ない.その ため,前もって対象試料に圧痕を付け,レーザー顕微鏡など で圧痕サイズと深さの関係を求めておく必要がある.また, 圧痕は切削により形を変えるため圧痕だけでは画像積層時の 位置合わせが難しく,組織全体を見て合わせる場合が多い. 最後の項目は顕微鏡写真から目的組織を抽出する際に障害と なる.組織写真になれていれば組織を抽出することは出来る が,数百枚の画像を手動で処理することは現実的ではない. そのため画像処理や機械学習などを使って組織の抽出を行う 必要がある.

組織の抽出は非常に大きな問題であるため、観察手法を変 えて組織の抽出を容易にすることが試みられている.よく使 われているのは走査型電子顕微鏡の反射電子像を使い組成差 で組織を識別する手法で、FIBを併用した解析例が多く報 告されている.一方,組成差がない場合や結晶方位について 定量的に解析したい場合は EBSD 測定を併用することにな る. EBSD 測定から得られる結晶方位データをそのまま三 次元で用いる手法もあるが、この章では測定結果から画像デ ータを作成しそのデータを用いて三次元組織を解析した例を 示す.図5は極低炭素鋼ラスマルテンサイトのブロック内部 の三次元観察結果である(15).極低炭素鋼ラスマルテンサイ トにはサブブロックと呼ばれる小角粒界で囲まれた組織を内 包しているが,光学顕微鏡では識別しにくいため EBSD 測 定からサブブロックを抽出し三次元像を作成している.図5 (a)は一つの切断面における結晶方位像で,画像の下部以外 は一つのブロックで占められている. そのブロック内に小角 の方位差を持つ組織が観察される. それらがサブブロックで ある.得られた EBSD データを解析し組織を抽出した後に 三次元像を再構築した. (b)は一つの旧オーステナイト粒に 含まれるパケットを示し、(c)は一つのブロックに含まれる ブロックを示している. (c)の色調(印刷版では明るさ)の異 なる組織は小角境界で囲まれたサブブロックであり、(c)に 含まれているほぼ同じ結晶方位を持つ領域を抽出した像が (d)である.このように結晶方位解析を併用することで通常 の観察では判別しにくい小角粒界などの組織を抽出し三次元 組織の観察を行うことが出来る.

局所結晶方位解析を絡めて三次元像を構築した場合,追加 で界面や長手方向などの結晶学的解析を行うことも出来る. 例として図6に極低炭素鋼ラスマルテンサイトのサブブロッ クの界面解析を挙げる<sup>(16)</sup>.ブロック内には入り組んだサブ ブロックが存在しているが,その一部を抽出し(a)と(b)に 示している.これらのサブブロック境界について前章で述べ た界面解析法で測定した結果が図に示されている.また,そ の応用で組織の長手方向も解析している.

ここで解析対象の三次元モデルについて少し考えてみる.



図5 EBSD 測定により組織解析を行い三次元像を構築した 例:(a)切断面における結晶方位図と(b)パケット,(c) ブロックおよび(d)サブブロックの三次元像.(a)は紙 面法線の結晶方位をステレオ三角の色(印刷版ではグレ ースケール)で表現している.(b)はパケットごとに色 を分けて表現している.(c)と(d)では結晶方位がほぼ 同じサブブロック集団が2種類あり,それらを色分け している.印刷版では組織をグレースケールで表現し ている.(オンラインカラー)

図6の三次元像は IMOD<sup>(17)</sup>という三次元像構築・可視化ソフトウェアを用いている.このソフトウェアでは顕微鏡像から界面を抽出し,微小な三角形(ポリゴン)で構成されたポリゴンモデルで界面を構築する.一方で Amira-Avizo<sup>(18)</sup>などのソフトウェアは,微小な立方体もしくは直方体(ボクセル)を単位胞として組織を構築したボクセルモデルを作成する.ボクセルモデルを用いた界面解析では,組織境界に平滑化処理を施してポリゴンモデルの界面を構築してから解析することになる.

ポリゴンモデルを構築するポリゴンには面法線のデータが 含まれており、これを使い界面解析を行うことが出来る.ソ フトウェアに依存するが、ポリゴンモデルを編集する事がで き、モデルに含まれるポリゴンの法線をベクトルとして抽出 するモードが存在していれば容易に任意の界面における面法 線の分布を得ることが出来る.

この解析を行う際に気をつけなければいけない項目とし て,観察時の位置精度と像歪がある.測定時の位置精度が悪 く像歪もあると画像をうまく整列させることが出来ず凹凸の ある三次元界面になる.そうなるとポリゴンの法線もばらつ く.また,切削深さについても注意する必要がある.多くの



図6 ブロック境界に内包されるサブブロックの解析:内包 されるサブブロックの中で(a)赤および(b)水色で示さ れる(印刷版では共に灰色)サブブロックを抽出し界面 法線と長手方向を解析している.(オンラインカラー)

ソフトウェアでは各切削ごとの切削深さを入力することが出 |来ず,平均切削深さを入力する場合が多い.そのような場 合, 各切削深さのばらつきがそのまま形状や方向, 面法線の ばらつきにつながる.等間隔に切削されていたとしても切削 深さと観察もしくは測定時の分解能が一致していない場合, そのままの精度で三次元構築を行うとボクセルの形状が立方 体から極端にずれてしまう. この状態でポリゴンモデルを構 築すると平滑化処理がうまくいかず、特定方向にポリゴンが 向く. そのため,三次元像構築の際には切削深さと二次元画 像の分解能(画像の場合はピクセル解像度)を合わせる必要が ある.具体的には切削間隔とEBSDのステップサイズがほ ぼ同じになるように測定し、二次元像のピクセル解像度と切 削間隔が等しくなるように下準備をするのがよい. ソフトウ ェアによってはボクセルサイズを変更できるものもあり、そ のようなソフトウェアを利用している場合は少し高めの解像 度を持つ二次元画像で三次元像を再構築し、その後ボクセル を立方体に近づけるという手もある.

#### 4. 三次元 EBSD による組織解析

FIB を用いたマルチスライス EBSD を用いれば,1µm 以下の空間分解能で結晶方位を含む完全な三次元組織解析が可

能である.ただし、コストや時間の観点から3D-EBSDの 対象は限られたものとなっている.3D-EBSDが有意性を発 揮する事例としては、粒界性格の特定、亀裂先端部等の変形 組織における微小方位変化の特定が挙げられる.粒界性格に ついては、例えば Rohrer らが用いている二次元断面観察か らの統計的再構築法により知ることもできる<sup>(19)</sup>.しかし、

例えば晶癖面を知ろうとしたとき,その晶癖面が不明瞭な場 合に二次元マップを用いて推定することは容易でない.また 内部方位回転のような小さな変化量を二次元データから再構 築することは困難である.例として、極低炭素鋼マルテンサ イトには図7に示すように変態歪の影響による微小な方位回 転が存在し、ある種の変形組織となっている. こうした回転 は二次元観察でも確認することができていたが、微細な結晶 粒周辺の変化を正確にたどるためには二次元観察だけでは不 十分であり三次元観察が決定的な役割を果たした. このよう に、実際の微細組織を可視化しながら作業を進めることがで きるため、二次元マップの統計値では見えてこない情報を直 接的に知ることができる. つまり, 何がその組織を特徴づけ ている量なのか「あたり」をつけることができる. 誤差の問 題から三次元測定したとしてもその差が有意であるかどうか を直ちに判定することは難しいが,「あたり」を付けた後で 二次元マップにより統計的な確認を行うことができる. 3D-EBSD による三次元結晶方位解析は、測定範囲や時間など の制約があることから適用事例が限定されるが、他の方法で は得られない貴重な情報を得ることができるという点で優れ ている.

3D-EBSD の三次元再構築も通常はボクセルモデルで取り



図7 極低炭素鋼マルテンサイト結晶粒の(a)粒内平均方位からの方位差,および(b)kernel average misorientation. 粒内の微小な回転が三次元的にどのように分布しているかを表す.(印刷版ではこれらの角度をグレースケールで表現している)(オンラインカラー)

扱う. 界面解析を行うときには,すでに記したようにポリゴ ンモデルに変換する必要がある. 詳細は割愛するが,ポリゴ ンモデルにもソフトウェアの内部的には様々な定義や制限が 存在し,データ構造やその取扱いはソフトウェアごとに仕様 が異なるという問題がある. 前章で紹介した部分的結晶方位 情報を用いる方法では通常結晶方位に関する情報は別に管理 するが, 3D-EBSD データでは各測定点(ボクセル)に結晶方 位情報が保持されるため,これらの情報をモデル変換時に継 承させ管理しなければならない. こうした処理はソフトウェ アの既定機能を使う場合に関しては利用者が強く意識する必 要はないが,独自のプラグインやスクリプトを開発する場合 はよく理解する必要がある.

二次電子もしくは反射電子像のようなスカラー量を三次元 再構築することは比較的容易である.しかし、ベクトル量 (テンソル量)を三次元再構築,可視化,解析する際には多次 元のベクトル量を適切に表示できないという問題がある.カ ラーコードで表現可能な単純なベクトルであれば表示可能で あるが、実際には正確に情報を表現できる場合の方が少な い. 例えば,結晶方位の情報量に対していわゆる結晶方位マ ップは試料座標系の方向が結晶内でどのベクトルに対応する かを表現しているだけであり、大幅に情報量が削減されてい る.このため、方位差が色の変化量に対応しないという欠点 を有している. ソフトウェア内でベクトル量を各ボクセルに 割り当て保持することは容易であり、結晶方位を保持した状 態で再構築すること自体は難しいことではない. 問題となる のは可視化および定量化するときに、結晶方位自体を表示す ることが事実上不可能であるため、結晶方位マップや方位差 のような次元や情報量を削減した値に変換する必要がある点 である.そして、その演算そのものや、その結果の解釈が複 雑になりやすいことであろう. さらに表示できたとしても, 三次元特有の問題として表面以外を見るためには断面等に加 工する必要がある.

このように、ソフトウェア内での処理という観点では結晶 方位データを含めて再構築することに問題はないものの、そ の値を適切に処理する機能は従来の汎用三次元解析用ソフト ウェアにはない、一方で測定機器メーカーが提供している結 晶方位解析ソフトウェアは三次元対応が進んでいない、幸 い、現在では DREAM.3D<sup>(20)</sup>を用いることで多くの結晶方 位に関する処理を行うことができる、三次元可視化ソフトウ ェアである ParaView<sup>(21)</sup>と連携することで、主だった処理と その可視化に関してはプログラムの作成を必要としない、た だし、二次元解析においても同じであるが、解析を行う際に は背景となる結晶学などへの知識が要求される、さらにソフ トウェアの操作に習熟する必要があるが、三次元解析はソフ トウェアの操作も複雑になっていることから学習コストはよ り高いものとなる.

以前は三次元解析に対応した結晶方位解析用ソフトウェア がほぼ存在していなかったため,結晶粒や方位差などのスカ ラー量に変換したうえで二次元マップを作成し,それらを三 次元再構築して可視化および定量解析を行っていた.三次元 解析に組織解析用のソフトウェアを用いることで専門的な機 能を利用できるという利点もあったが,結晶方位を扱うとき に積層まで戻らないと任意の情報を可視化できないというも どかしさがある.一部の三次元解析ソフトウェアは別途ベク トル情報を埋め込むことも可能であるが,ベクトル情報を処 理するために専用のスクリプトを自前で作成する必要があ り,そのための環境もすべて三次元解析ソフトウェアごとに 変わるため,容易とは言えなかった.特に結晶方位の計算に おいては回転対称を考慮する必要があるため,材料系研究者 にとっては時間的には困難であった.また測定時の座標系に 関する情報が共有されておらず,個別に測定機器メーカーに 問い合わせる必要があることも混乱に拍車をかけていた.こ うした課題は DREAM.3D と ParaView の進歩により大幅に 緩和されており,三次元結晶方位解析を一般化するためのソ フトウェア基盤が整いつつある.

# 5. DREAM.3D と ParaView による三次元再構築と 結晶方位解析

ここでは DREAM.3D と ParaView を用いた作業の流れを まとめる.他のソフトウェアを使う場合でも、マルチスライ ス法を用いている場合は大まかな流れは同様のものとなる. DREAM.3D はマルチスライス法で得られたマップを積層 し、三次元データセットに変換するとともに、結晶方位を基 にした各種の解析を可能にする.二次元の結晶方位解析ソフ トウェアは基本的に可視化の機能を併せ持つが、 DREAM.3D 自体は可視化機能を持たない.代わりに、三次 元モデルの汎用可視化ソフトウェアである ParaView を使っ て可視化を行う.ParaView はグラフィカルインターフェー スを有し、習熟が必要であるが基本的機能は直観的に操作で きる.また、ParaView は Python スクリプトにより複雑な 制御が可能なため、スクリプトを用いればユーザーが指定し た性質(計算結果)を自在に描画させることができる.

前章で記したように結晶学や EBSD 測定の知識は必要で あるが、DREAM.3D を用いることで容易に三次元再構築と 解析を始めることができる. ParaView による可視化作業は 一定の習熟が必要となるが、これは他の三次元解析ソフトウ ェアでも同じことが言える. 独自の解析を行うに際しても、 DREAM.3D と ParaView はオープンソースソフトウェアで あり、ソースコードを理解する能力があれば比較的容易にこ れらを利用したプログラムの作成が可能である. 言い方を変 えれば、多くの処理が測定機器メーカーの用意した解析ソフ トウェアで済んでしまう二次元結晶方位解析と比較して、三 次元結晶方位解析ではソフトウェア操作の習熟や解析作業に かなりの手間がかかるという点は注意が必要である.

ここからは DREAM.3D を用いた標準的な三次元再構築 に関して説明する. DREAM.3D も含めて,標準的な三次元 再構築ソフトウェアはボクセルモデルを用いて再構築を行 う.従って,二次元マップは正方形グリッドを用いる必要が ある.六角形グリッドで測定した場合は変換が必要である. 次に,通常はスライス間の揺動が起きるので,スライス面内 の揺動補正が必要になる.粒界がはっきりしている組織であ れば,結晶粒重心などを用いた方法で比較的うまくいくよう である.しかし,圧延組織のように組織自体が方向性を持つ 場合はうまく補正できない場合が多く,FIB 加工した外周 部を使うなどの工夫が必要である.

揺動補正が終われば後は積層を行い,三次元モデルを構築 する.この際,二次元マップの座標系(特に結晶方位の基準 座標系)と三次元モデルの座標系をきちんと紐付ける必要が ある.EBSDの測定機器メーカーに応じて基準座標系のとり 方が異なるため注意が必要である.DREAM.3Dにはこれら の変換を多くの場合において問題なく行えるような仕組みが 実装されており,測定装置の状態を正しく把握していれば問 題は起きない.DREAM.3Dは結晶粒,方位マップカラー, kernel average misorientation などの計算を行うことができ る.また,結晶粒界性格などの複雑な計算を行うこともでき る.DREAM.3Dは結果を ParaView 互換の形式として保存 するため直ちに可視化の作業に移行することができる.ま た,結晶粒の体積などの単純な定量データを出力するのであ れば,DREAM.3Dからテキストとして出力することができ る.

三次元構築が終了すれば, ParaView 側で様々な可視化が 可能になる.また ParaView は任意の断面を描画し,断面位 置を変化させてアニメーション表示をするなどの解析が可能 なため,一目では理解しにくい三次元構造を詳細に解析する ことができる.また,主要な三次元表示ソフトウェアが有す る基本的な機能を備えている.例えば,閾値以上のある値を 持つ結晶粒だけを表示し,さらにその断面を表示するという ようなことが可能である.事前に準備しておく必要がある が,変位のようなベクトル量がある場合,それらを矢印等で 三次元モデルの近傍に表示するようなことも可能である.

解析と可視化を行う上で,界面解析の場合はポリゴンモデ ルへ変換する必要がある. さらに界面解析においては平滑化 が必須となる<sup>(22)</sup>. DREAM.3D はそれらの処理を標準プラ グインで行うことができる. さらに,比較的単純なアルゴリ ズムを用いる場合は ParaView 側で結果を確認しながら平滑 化を行うことも可能である.一歩進んだ解析として,三次元 観察の結果を二次元断面と比較するときは,ボクセルもしく はポリゴンモデルを任意の平面で切断し,ピクセルもしくは ニ次元の多角形モデルへと変換して解析を行う必要がある. このような解析を ParaView のグラフィカルユーザーインタ ーフェースだけで行うことは難しいが,スクリプト環境を用 いることで元の結晶方位などの情報を継承したまま処理を行 うことが可能である.

容易になったとはいえ,例えば ParaView による可視化や 形態定量には課題も多い.操作への習熟に時間がかかること はもちろん,材料系研究者が必要とするような専門的な形態 解析の機能が不足している面がある.また,形態計量のため のフィッティング等を行う場合,他のソフトウェアでもそう であるが,プラグインやスクリプトにより自前のプログラム による処理を作成し実行することが必要になるであろう. そ ういった処理の際に三次元特有の問題として、ボクセルやポ リゴン等のモデルごとの扱いの違いや、ソフトウェアごとに 大きく異なる内部設計への対応が必要となる.二次元データ であれば比較的単純であることから、ソフトウェアごとの違 いも対応しやすい.しかし、三次元データは複雑で、さらに 用途に応じて様々なデータ構造が存在するため、これらに対 応することは二次元と比べて格段に手間がかかることにな る. この影響は可視化ソフトウェアの操作にも表れていて, 例えば表面の法線ベクトルを計算するにしても、ボクセルモ デルからポリゴンモデルへの変換が必要となるなどの制約や 余計な手順が発生する. こうした要素一つ一つはそれほど難 しいことではないが、多数の要素が積み重なるため、内部の データ構造や処理の流れを理解していない場合には複雑怪奇 な操作を強いられることとなり、操作の習得が難しく時間の かかるものとなる.現在のところ,結晶学から始まって,三 次元データ構造やコンピューター上での表現法、いくつかの 代表的処理のアルゴリズム等に関する理解は必須である. そ のような基礎知識がある前提であれば、近年のソフトウェア 側の進歩により、以前よりはるかに明確で再利用性の高いソ フトウェア作成環境が整いつつあり、「比較的容易に」材料 系研究者が必要とする処理を書くことができるようになって いる.

#### 6. 今後に向けて

様々な機器やソフトウェアの開発により EBSD を併用し た三次元組織解析や 3D-EBSD による組織解析は身近な観 察手段となってきた.しかし,いくつかの問題点が残ってい る.その一つに比較的マクロな肉眼から光学顕微鏡組織に対 しての分解能の高い三次元結晶方位解析が難しい事が挙げら れる.これは SEM 筐体内での加工では加工範囲が限定され る事が要因である.この問題に関しては SEM 筐体内でレー ザ加工できる機器などいくつかの解決法が出ており,いずれ 解決すると考えている.

情報量が増えると単純に処理できなくなったり,処理でき ない膨大なデータにユーザーが困惑する事になる.処理に関 しては解析用計算機の高性能化が期待できるのでそこまで問 題にならないと考える.データの処理に関しては,考えるべ き因子が多いので,マテリアルズ・インフォマティクスのよ うな機械学習や理論計算の支援を受けて解析することになる と予測される.また逆に精度の高い三次元データが理論構築 やデータベース構築の助けにもなると考えている.

金属組織は力学特性など各種特性と関連づけ解析される. 今後,金属組織の結晶学的特徴を含めた三次元構造が明らか になることで理論的な解析や各種シミュレーションとの連携 も進み,組織制御の効率化や新たな組織制御法の開発が期待 される.そのためにも結晶学的な三次元組織観察が増えるこ とを期待する. 本稿の図2は東北大学金属材料研究所との共同研究(No. 20K0028)で得られた結果の一部を示している.また,図7 は島根大学次世代たたら協創センターの機器で測定した結果 を解析している.この場を借りて謝意を表する.

#### 文 献

- (1) 牧 正志,下岡貞正,梅本 実,田村今男:日本金属学会誌, 35(1971),1073-1082.
- (2)坂 公恭:結晶電子顕微鏡学,内田老鶴圃,(1997),26-38.
- (3) 足立吉隆,小山敏幸: 3D 材料組織・特性解析の基礎と応用, 内田老鶴圃,(2014), 25-30.
- (4)古城直道,横田秀夫,藤崎和弘,山形 豊,小久保光典,姫 野龍太郎,牧野内昭武,樋口俊郎:精密工学会誌,74(2008), 587-592.
- (5) N. Sato, Y. Adachi, H. Kawata and K. Kaneko: ISIJ Int., 52 (2012), 1362–1365.
- (6) Y. Lu, M. Wang, Z. Wu, I. P. Jones, M. Wickins, N. R. Green and H. C. Basoalto: MRS Communications, 10(2020), 461– 466.
- $(\ 7\ )\ M.$  Cantoni and L. Holzer: MRS Bulletin,  $\mathbf{39}(2014),\ \mathbf{354}\text{--}\mathbf{360}.$
- (8)竹内 榮,本間敏夫,池田 晋:日本金属学会誌,22(1958), 320-323.
- (9) 竹内 榮,池田 晋:日本金属学会誌, 22(1958), 324-327.
- (10) B. D. Cullity, 松村源太郎 訳:新版カリティX線回折要 論,アグネ,(1980),211-230.
- (11) 横江大作:まてりあ, 60(2021), 645-652.
- (12) G. Krauss and A. R. Marder: Metall. Trans., 2(1971), 2324– 2357.
- (13) 榎本正人:鉄と鋼, **90**(2004), 183-189.
- (14) Y. Edamatsu, S. Morito, T. Ohba, Y. Adachi: Journal of The Japan Society for Heat Treatment, 49 (2009), 632–635.
- (15) 森戸茂一, A. H. Pham, 大庭卓也, 林 泰輔, 古原 忠, 宮 本吾郎:まてりあ, 55(2016), 594.
- (16) S. Morito, Y. Adachi and T. Ohba: Mater. Trans., 50(2009), 1919–1923.
- (17) https://bio3d.colorado.edu/imod/
- (18) https://www.fei.com/software/avizo3d/
- (19) G. S. Rohrer, D. M. Saylor, B. El Dasher, B. L. Adams, A. D. Rollett and P. Wynblatt: Z. Metall., 95 (2004), 197–214.
- (20) http://dream3D.bluequartz.net/
- (21) https://www.paraview.org/
- (22) S. B. Lee, G. S. Rohrer and A. D. Rollett: Model. Simul. Mater. Sci. Eng., 22 (2014), 025017.

#### ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 森戸茂─

1997年 筑波大学大学院博士課程工学研究科修了 1997年10月~2005年1月 京都大学工学部材料工学科 助手 2005年2月~2019年4月 島根大学総合理工学部物質科学科 助教授(法改正 により2007年に准教授,改組により2012年に大学院総合理工学研究科物理・ 材料科学領域へ変更) 2019年5月-現職 専門分野:金属組織学,電子顕微鏡

- ◎鉄鋼材料に含まれるマルテンサイト組織の解析と評価を主軸に、金属材料
- の組織評価と組織制御に従事. **\***



森戸茂一

林泰輔



1-4-1 はじめに

金属組織学という学問分野があるように金属系材料にとっ ては組織に関する知見を得ることが極めて重要です.その組 織観察の際に不可欠な技術が,試料の形状調整と表面研磨技 術です.どんな顕微鏡の達人でも,表面状態の劣悪な試料で は意味のある組織観察はできません.本項では,光学顕微鏡 や SEM を用いた組織観察時に必要となる試料形状の調整や 研磨方法についての初歩を概説します.

#### 1-4-2 試料形状の調整

#### 1-4-2-1 試料ステージ駆動と対物レンズとの関係

組織観察が必要となる試料の大きさは、溶解・凝固させた ようなインゴット状の大きなものから、僅かに合成できた微 粒子状まで様々でしょう. ある程度の大きさを有する試料の 場合には、観察に用いる顕微鏡のステージ範囲内となるよう に最終的な試料形状を決めてから以下に述べる切断加工を行 っていきます(図1参照).特に,試料の高さ,試料表面の凸 凹に配慮が必要です. 例えば, 光学顕微鏡の場合には, ステ ージZ軸の最大移動距離から作動距離(Working distance: WD)を差し引いた長さが、試料表面にピントを合わせられ る最大高さとなります. WD は用いる対物レンズに依存し ますので注意してください. SEM の場合には, 取り扱い説 明書などに試料高さの制限値が明記されていますので、確認 しておきましょう. 試料表面の凸凹については, 平面である ことが最適ですが、試料全面を平面状に加工できない場合も あります.光学顕微鏡では、対物レンズレボルバーの回転時 に、横方向から直接視認できない SEM の場合には試料移動 時に,接触の危険性が高くなります.いずれの場合にも,ス テージの動きや対物レンズとの位置関係を事前に確認してお くことが必要です.ステージを最上位位置から下限位置まで 移動させたり,XY 方向の最大値まで移動させたりしてみま



図1 試料のどの箇所を観察するのかを認識してから切断加工 を行うことが必要です.

(a)は棒状の試料,(b)はその加工方向を模式的に示していま す.例えば,(b)に示すように,長手方向に沿った組織変化を 見るのであれば,その方向が表面に現れるように切断,研磨を 行っていきます.特定の方向から組織を観察しないと,目的と する解析ができない場合もあります.この場合にはその方向が 表面に現れるように傾けて切断し,研磨加工を行います.断面 組織の場合,試料の内部ではなく,表面のごく近傍を観察した いときには,切断後,試料を樹脂に包埋してから研磨加工を行 って表面近傍の組織を出していきます.樹脂包埋することで, 研磨ダレも防げます.(c)は樹脂包埋した試料の一例です. SEM 観察を行う場合には,(c)に示すように導電性の高いCu 箔で周囲を覆うと便利です.

試料の高さや,表面の凸凹は,例えば(d)に示す光学顕微鏡 の場合,ステージを最も下げた位置から対物レンズ下端までの 距離から,用いている対物レンズのWDの値を,差し引いた 距離が試料の最大高さとなります.対物レンズを切り替えるレ ボルバー回転時に,レンズと試料表面が接触しないかも確認が 必要です.

試料加工においては,最終的な形状を念頭において,部材から加工していくことが重要です.

\* 名古屋大学大学院工学研究科 物質プロセス工学専攻;准教授 Keywords: optical microscope, scanning electron microscope, microstructure, sample preparation, polishing (光学顕微鏡,走査電子顕微鏡,組織,試料調整,研磨) 2021年11月12日受理[doi:10.2320/materia.61.101] しょう. SEM の場合には,これ以外にも,回転,傾斜機構 もあります.特に傾斜については注意が必要です.ステージ を動かすときには,ぜひ,くしゃくしゃにした小さなアルミ ホイルを置いて試してみてください.試料表面とステージ調 整の関係や,レボルバーを回転させたときなどの状況がよく 理解できますし,万が一の場合にも,対物レンズに対するダ メージは高くありません.

#### 1-4-2-2 試料の大まかな形状調整<sup>(1)(2)</sup>

観察対象となる組織を考慮し,試料のどの箇所を観察する べきなのかについて十分検討してから,形状調整を始めまし ょう.インゴットであれば部材の表面近傍は避けるべきでし ょうし,単結晶であれば切り出し方位を考慮しなくてはなり ません.目的とする観察箇所が最終的に試料表面位置となる ように,後述する研磨加工分も含めて,形状の調整を行いま す.金属系材料の場合には,切断加工によって歪や変質層が 現れます.このことを念頭において試料の加工法を選択しま す.

大型の部材から切り出すときには、バンドソー、ジグソ 一,金ノコなどが使えます.鉄鋼系の材料や硬度・強度に優 れた合金の場合には,鉄鋼系の切断刃(工具材料)は適しませ ん. アルミナなどの砥粒が含まれている回転刃を用いた切断 機を用います.加工対象が薄板状の場合で、かつ、アルミニ ウム合金などのように切断しやすい場合には、カッター、強 カニッパー,糸ノコなどで手軽に切断することも可能です. 1mm 程度のアルミニウム合金の薄板であれば、カッターで 十分切断可能です. ただし, これらのラフな切断方法を用い ると、切断面近傍の加工変質層だけではなく、切断時に部材 を曲げてしまったり、応力をかけてしまうことで生じる転位 組織の変化や歪、相変態なども誘起されますので、留意くだ さい.以下は、ラフな加工を経て20mm程度にまで調整さ れた試料の加工について説明します. この程度の大きさであ れば、小型の切断機が適しています(図2参照).この切断機 は、回転刃を用いて、ステージ移動による強制で、もしく は、重力(調整用の重りも含めて)で、試料を切断刃に対して 移動させて切り込んでいきます.回転刃(一般にブレードと 呼ばれます)には、ブレード全体が刃として機能するもの、 座金部分の外周部に砥粒が結着されているもの、また、切断 に使用する砥粒が、ダイヤモンド、アルミナ、SiC、BN、 など様々な種類が用意されています.研磨剤などを取り扱っ ているメーカーのカタログなどを確認すると、ブレードがど の材料に適しているかなど明記されていますので、ぜひ参考 にしてください(Web で多数検索できます). 金属材料の場 合には、ブレードが目詰まりしやすいため、ブレードのフラ ッシング(砥石のようなもの)を定期的に行います.ブレード の切断具合が劣化してきたからと言って、すぐにブレードを 交換する必要はありません.小型棒状のフラッシング部材が 用意されていますので、定期的にこの部材を切断することで ブレードの切れ具合を良好に保つことができます. 試料の固 定は、ネジで絞めこんで固定する場合や、例えば、厚めのス ライドガラスに専用樹脂を用いて試料を固定し、そのガラス

図2 小型精密切断機の一例(ブレードとの位置関係を見えや すくするために、スライドガラスを取りつけている). 一度、スライドガラスを取りつけて少し切り込んでみると、切 断位置を確認することができます.図中矢印で示した試料位置 調整のためのマイクロメーターを動かす場合には、必ず、一定 方向にのみ回転させていくようにして、試料を移動させます.

ごと切断する方法があります.切断する幅が決められている 場合には、一度、試料端を切断して初期のブレード位置を決 めてから、ブレード厚さ+指定の厚さ、だけ試料を移動させ ていきます.この時に、試料の位置駆動のためのマイクロメ ーターやハンドルは必ず一定方向へ動かす習慣をつけておき ましょう.試料の移動中に回転方向を変える(反転させる) と、誤差が非常に大きくなります.切断できる試料厚さは、 0.5 mm 程度が限界と考えてください.加工歪などを考慮す ると、もっと厚めに切断して、その後は、後述する研磨加工 で調整していくことを強く薦めます.

#### 1-4-2-3 その他の切断方法

前項で紹介した方法は,ごく一般的に使用されている切断 加工方法でした.これ以外にも,より高度な切断方法が知ら れています.

•ワイヤーソー:加工変質層を低減できる方法として用いら れます.回転する糸に砥粒を垂らして,その砥粒で切断して いく方法です.細い領域を研磨しながら切断していくという イメージでしょうか.切断には時間を要しますが,例えば, 上述したブレード回転型とは比較にならない程度まで,加工 変質層を低減できます.ワイヤー切断機では,切断に使用す る研磨砥粒の種類が加工変質層の程度に影響します.切断対 象と用いる砥粒についてはメーカーで参考資料が用意されて いますので,参照ください.

• 放電加工:名称の通り,放電させながら切断していく設備 です.ごく狭い範囲を放電させて溶解していきます.溶解さ せますので,切断面近傍には,溶解・急冷されたときの変質 層が形成されます(回転刃での切削よりも変質層は大きく増 加します).ここまで述べた切断法での加工変質層への配慮 だけではなく、切断時の熱の影響もより広い範囲に及ぶ可能 性があるので注意が必要です.類似の手法として、YAGや 炭酸ガスレーザーなどを用いて、局所的に溶解させながら切 断していく方法もあります.

 オシレーション切断:回転刃に対して試料が移動する切断 機の場合には、切り込み量を小さくして、何度も試料を往復 させて切り込み深さを増加させていくオシレーション切断法 が利用できます.この方法を用いると、一回で切断させる場 合と比較して、切断面の加工変質層を薄くすることが可能と なる場合があります.

#### 1-4-3 研磨

#### 1-4-3-1 機械研磨<sup>(2)</sup>

光学顕微鏡を用いた金属組織観察用の試料表面は、一般に 粗研磨,精研磨,仕上げ研磨(一般にバフ研磨ということが 多い)の工程を経て研磨されます. 粗研磨や精研磨は, 固定 した研磨紙を用いて乾式もしくは水で濡らした湿式にて手動 で研磨するのが一般的です.研磨紙(エメリー紙と呼称され ることが一般的です)は、紙の上にアルミナ系(または炭化ケ イ素)の砥粒をバインダーに混ぜて塗り、固めた研磨紙のこ とを指します(砥粒は固定されているので固定砥粒となりま す).研磨砥粒の大きさに従って分類されており、研磨紙の 番号nは, 砥粒の粒子径が 25.4/n mm を意味しています. 研磨紙番号が大きいほど砥粒が細かくなります. したがっ て、小さい番号のエメリー紙を用いて粗研磨を行い、徐々に 大きい番号のエメリー紙に変えて精研磨していくことになり ます.その後,回転する研磨盤(バフと呼ばれる研磨布を敷 いている場合が多い)の上に、金属試料を手で保持し、研磨 剤を滴下(補充)しながら仕上げ研磨を行います. この研磨剤 は含まれている粒子の大きさで分類され,数 µm のものから 徐々に微細な粒子のものに変えていきます. 粒子の材質はア ルミナ,ダイヤモンド,酸化ケイ素粒子(コロイダルシリカ と呼ばれる水溶性懸濁液)など種々用意されています.研磨 剤の適切な濃度や滴下量は材質だけでなく、研磨盤上のバフ 布(布の柔らかさ、毛の長さ)によっても変化するため、その 最適化には試行錯誤する必要があります.

試料を手で保持して研磨する場合,試料が研磨盤の回転に 引っ張られて,持っていかれない程度の力で保持しながら, 研磨盤の中心から外周までの幅を有効に使って研磨するとよ いと思います.試料の保持に過度の力を入れると,研磨面に 傾きを生じ,平坦性が失われることによって研磨面が丸みを 帯びること(しばしば「ダレる」と表現されます)があります ので,注意してください.順に砥粒の粒径を細かくしていく 作業のことを,番手を変えていく,と表現したりします.精 研磨時に,この番手を変えるときには,必ず,光学顕微鏡を 用いて,研磨傷を確認していきましょう.一つ手前の研磨傷 が残っている状態で,次の番手に移っても研磨時間が長くな るだけです.例えば,番手を変えるごとに試料を直角に持ち 替えるようにすると,番手ごとの研磨傷の残りを確認しやす くなります.試料表面に観察される機械研磨で導入された傷



図3 アルミニウム合金の研磨面と研磨工程の一例. (a)自動回転研磨装置の外観,(b)800番エメリー紙,(c)1200 番エメリー紙,(d)2400番エメリー紙,(e)粒子径3µmのダイ ヤモンド粒子を含む研磨剤,(f)粒子径0.04µmの二酸化ケイ 素粒子を含む研磨剤 研磨に用いる砥粒が細かくなるにつれて,線状の研磨傷がなく なっていくことが分かります.(f)のような研磨面状態を鏡面

と呼びます. 鏡面状態の表面は非常に平滑度が高いため,内部 の組織は,このままでは観察できません. 組織を現出させるた めの腐食(エッチング)が必要となります.

が全く見えなくなれば、研磨は終了です.図3に、研磨を行 う人の技術の差が出ない自動回転研磨装置(図3(a))を用い たアルミニウム合金の試料表面の機械研磨に伴う研磨面状態 の変化(光学顕微鏡像)を示します.エメリー紙の番号を800 番から2400番に増やしていくと,研磨による試料表面の傷 が徐々に細かくなり、金属組織に由来するコントラストが見 えるようになってきます(図3(b)-(d)). 更に微細な粒子の 研磨剤を用いた仕上げ研磨後,機械研磨による傷が見えなく なる(しばしば「鏡面になる」と表現されます)のがわかりま す(図3(e),(f)). この「鏡面」状態では、光学顕微鏡を用 いた組織形態の観察は困難です. そのため, 機械研磨を施し た試料表面に腐食(エッチング)処理を行い,試料表面に金属 組織に由来する凹凸を付けた表面を観察します. 腐食(エッ チング)処理の条件は材料によって様々ですので、先行研究 や他の専門書(3)-(5)を参考に自分の試料に適した条件を模索 する必要があります.

#### 1-4-3-2 電解研磨

アルミニウムのような軟らかい金属では、上述したように 切断加工や機械研磨によって試料表面に加工変質層が発生し やすいことが知られています.加工変質層は組織観察に影響 するばかりではなく、例えば、試料表面近傍の結晶方位情報 を取得する電子線後方散乱回折(EBSD)法を実施する場合など の表面に敏感な計測を行うときにも、しばしば問題となりま す.加工変質層の除去法の一つとして、試料表面の電解研磨 が効果的です.この加工変質層の除去は、試料表面における 局所的な力学特性を評価するナノインデンテーション試験<sup>(6)</sup> やマイクロ機械試験<sup>(7)(8)</sup>に供する場合も必須となるでしょう.

電解研磨を試料に施す前処理として,機械研磨による試料 表面の「鏡面」仕上げは必ずしも必要ありません.最適化さ れた条件での電解研磨は,試料表面を平坦にします.電解研 磨装置の外観を図4(a)に示しますが,電流計と電圧計が付



図4 (a)汎用の電解研磨装置の外観,(b)電解研磨時の電圧と 電流の関係の模式図,(c)粒子径0.04 mmの二酸化ケイ 素粒子を含む研磨剤で仕上げたアルミニウムの表面と (d)それに過塩素酸を用いた電解研磨を施した試料表面 の光学顕微鏡組織写真 条件にも依存しますが,電解研磨時に慎重に電圧を高くして

条件にも低存しますが,電産が居時に展里に電圧を高くして いくと,(b)に示すように電流が一定となる条件が現れます. 一般的な電解研磨はこの条件の範囲内で行います.

いた直流電源装置とワイヤーにつながる陰極板, 試料(試料 表面は陽極となる)をつかむピンセットから成る単純な装置 構成です. 電解槽(多くの場合ビーカー)内に電解研磨溶液 (材料によって研磨液は異なります)を入れ、陰極板と試料を 溶液に浸し,通電します.その際,電圧を徐々に上昇させ, 電流の変化を見ることが重要になります. 最初は電圧を上げ ると,それに伴って電流値も上がります.この電流値が,試 料表面から金属が溶けている量に依存する値です.更に電圧 を上昇させていくと、電流が電圧の増加にかかわらず一定に なる値が見つかります. この状態が良好な電解研磨の電流・ 電圧条件と一般に理解されています.図4(b)に、電解研磨 時の電圧と電流の関係の模式図<sup>(5)</sup>を示します.実際,著者も 未知の材料の電解研磨の条件を探るとき、この電流一定の条 件を見出すようにしています. 一般の電解研磨は試料表面を 平坦にしますが、いくつかの相から成る組織(複相組織)であ る場合、溶解速度の差を利用して試料表面に組織形態に由来 する凹凸をつけることも可能です(図4(c),(d)). そのた め、組織形態を反映した明瞭なコントラストを得ることが可 能となり、美しい光学顕微鏡像を撮影することができます. 図4(c),(d)で示した光学顕微鏡像は、金属3Dプリンタ技 術のひとつであるレーザ粉末床溶融結合法で積層造形した Al-Si 合金の組織形態<sup>(9)(10)</sup>を示しています. レーザ照射に よる局所溶融・急冷凝固した溶融池(Melt pool)の形状が明 瞭に観察されています. この溶融池境界近傍の比較的粗大な Si 相が母相との凸凹を生み出し、コントラストを生み出し ています.なお、電解研磨を施すと試料表面に機械研磨によ る研磨傷が現れてくることもあります(図4(d))(この理由は 機械研磨時に生成した加工変質層に由来する金属の溶解速度 の局所的な違いと思っていますが、正確な理由はわかりませ ん). 電解研磨条件の最適化は慎重に決める必要があります.

#### 1-4-3-3 イオン研磨

硬い相と軟らかい相が混在する複相組織で構成される材料 や全く異なる機械的特性を有する材料を組み合わせた複合材 料などにおいて、均一に研磨された試料表面を作製するに は、熟練の研磨技術が必要でした.近年、イオン研磨(イオ ンミリングと呼ばれます)技術は飛躍的な進歩を遂げ、複合 材料や難加工材料においても、ほとんど物理的損傷等を伴う ことなく試料表面を均一に研磨仕上げすることが可能になっ ています.特に、金属材料の表面に硬質もしくは軟質材料が コーティングされているような試料の断面を観察する場合に 有効です.コーティング材と母材の研磨特性が異なるため、 機械研磨による平滑な試料表面の作製は機械研磨では実現で きません.しかし、このイオン研磨技術の進歩はその問題を 解決し、例えば著者の溶融アルミニウムめっき<sup>(11)</sup>や亜鉛め っき<sup>(12)</sup>鋼板の研究に不可欠な研磨技術となっています.

市販のイオン研磨装置であるクロスセクションポリッシャ<sup>(13)</sup>(日本電子㈱製,図5(a)参照)を例に挙げて,イオン研 磨によるSEM観察用試料の作製方法を述べていきます.高 真空下のチャンバー内にてアルゴンイオンビームを照射し, 試料と同時に遮蔽板(シールドプレート)と呼ばれる試料を押 さえる板の断面を加工する装置です.加速電圧が可変なアル ゴンイオンビームを用いて,試料断面表層部を比較的精密に 加工することができ,平滑かつ加工変質層が極めて少ない試 料表面を得ることができます.溶融アルミニウムめっき鋼板 の断面観察を行うために,イオン研磨を施した試料のSEM



 図5 (a)汎用 SEM での観察用試料調整に有用なイオン研磨 装置の外観,イオン研磨によって加工された試料表面 の,(b)低倍率,(c)高倍率の SEM 像,および,(d)-(g)イオン研磨表面から取得した EBSD パターンと指数 解析結果((d),(f)は(c)中に示した(d)の箇所,(e),(g) は(e)の箇所から取得).

(c)に示すように研磨が非常に困難なAlめっき皮膜と金属間 化合物との界面近傍においても、(d)に示すような明瞭な EBSDパターンが得られている. 二次電子像を,図5(b)に示します.イオン研磨された試料 表面には、イオンビーム照射(図中上方向から)による加工跡 が観察されます. イオン研磨中には、紙面垂直方向を軸とし て試料が約30°左右に回転している(スイングしている)た め, 試料表面には, V字状の研磨領域(図5(b))が現れま す. この試料は、アルミニウムと鉄という異なる性質の材料 を組み合わせているだけではなく、その界面には脆性的な金 属間化合物相も存在するのですが(図5(c)),イオン研磨表 面は平滑に研磨されていることがわかります(図5(b)).ま た加工変質層が極めて少ない表面であるため, SEM 反射電 子像には組織に対応する明瞭なコントラストが観察されるば かりでなく(図5(c)), EBSD パターンの取得も可能です(図 5(d), (g)). SEM 観察と EBSD 解析を組み合わせて使用す る研究者にとっては、理想的な試料表面が調整可能です.一 見とても便利に見えるイオン研磨においても、加速電圧や遮 蔽板と試料の相対位置の調整など様々な条件を調整し、最適 化するための試行錯誤は必要であることも申し添えておきま す.

SEM 観察用の試料作製にとても有用なイオン研磨です が、気を付けなければならない点もあります.例えば、多く の気孔が内部に存在するような材料(例えば、ポーラス材料) の試料表面では、穴の内部表面の影響を受けて不均一に研磨 されます.図6に多数の気泡を内包するアルミニウムのイオ ン研磨後の試料表面を示します.低倍率の観察では一見平滑 な表面に見えますが(図6(a))、イオンビーム照射方向の上 側から穴に沿って尾を引くような研磨跡が観察されます(図 6(b)).この研磨跡は試料表面の凹凸に対応し、組織観察に は不向きな試料表面となります.したがって、イオン研磨を 行う場合、試料内部の構造(空隙の有無)に注意を払う必要が あります.

より高度なイオンを用いる加工法として、Ga イオンを用 いた FIB (Focused Ion Beam)加工法も有用です(Ga イオン だけではなくOs イオンを用いる機種もあります). この FIB 加工法は、イオンビームをより細く絞れるため、~10 nm 程度の加工分解能を実現できます(機種に依存します). ただし、上述したイオン研磨装置と比較して、加工領域が小 さいこと(数 100 µm 程度以下)や、高度な加工技術が必要と なります.光学顕微鏡や SEM 観察のための試料調整には、



図6 多くの気孔を内包するアルミニウムのイオン研磨後の試 料表面.

(a) 低倍 SEM 像, (b) 高倍 SEM 像. (a) の矢印の範囲はイオン研磨された箇所. (b) に認められるように,気孔の箇所から下方向に線状の研磨ムラが確認されます.

イオン研磨装置が適しているでしょう. FIB 加工については、「TEM 観察のための試料調整」を参照ください.

#### 1-4-4 おわりに

金属材料を対象に光学顕微鏡および SEM を用いた組織観 察に必要な切断加工と研磨方法の原理と技術の初歩を説明し てきました(TEM 観察のための試料調整については 1-7 を 参照ください).今回ご紹介した研磨技術は,ほんの一握り の情報と思います.今では簡単にインターネットを使って情 報を手に入れることができますので,さらに知りたいことが あれば積極的に調べてみましょう.ですが,今も昔も切断加 工・研磨技術は試行錯誤によって確立されたものがほとんど です.ですので,本当に良い組織観察用の試料を作製するた めには,自身で材料を触って,切って,磨いてみることが必 要になると思います.金属の研磨を通して,リアルな金属を 体感してくださいね.ぜひチャレンジしてみてください.

#### 文 献

- (1) 山本剛久, 仁平正三: セラミックス, 33(1998), 56-60.
- (2) 工具については,例えば,澤 武一:トコトンやさしい切削 工具の本,日刊工業新聞社(類似の書籍は,Webで多数検索 できます).
- (3) Günter Petzow:金属エッチング技術,松村源太郎訳,アグネ (1977).
- (4) Günter Petzow:金属・セラミクス・プラスチック 組織学と エッチングマニュアル,内田裕久,内田晴久訳,日刊工業新 聞社(1997).
- (5)金属組織の現出と試料作製の基本,材料技術教育研究会編, 大河出版(2008).
- (6) A. C. Fischer-Cripps: Nanoindentation, Springer (2010).
- (7) J. R. Greer and J. T. M. De Hosson: Prog. Mater. Sci., 56 (2011), 654-724.
- (8)竹安崇一郎,高田尚記,鈴木飛鳥,小橋 眞:軽金属,68 (2018),250-256.
- (9)高田尚記,小平寛久,関沢圭人,鈴木飛鳥,小橋 眞:軽金 属, 67 (2017), 582-588.
- (10)高田尚記,鈴木飛鳥,小橋 眞:鋳造工学,91(2019),612-617.
- (11) N. Takata, M. Nishimoto, S. Kobayashi and M. Takeyama: Intermetallics, 67 (2015), 1–11.
- (12)高田尚記,早野邦尚,鈴木飛鳥,小橋 眞:鉄と鋼,105 (2019),701-708.
- (13) IB-19530CP クロスセクションポリッシャ™ 断面試料作製装置, JEOL 日本電子㈱ https://www.jeol.co.jp/products/ detail/IB-19530CP.html

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
 2006年3月 九州大学 大学院 総合理工学府 博士後期課程修了
 2006年4月 大阪大学 大学院 工学研究科 特任研究員
 2007年10月 東京工業大学 大学院 理工学研究科 助教
 2015年9月-現職
 専門分野:材料組織学,材料強度学

高田尚記

◎鋳造・鍛造,積層造形,溶融めっき等の異なる材料 創製プロセスが生み出す組織形成の理解とそれに基 づく材料・プロセス設計に関する研究に従事.ま た,マイクロ機械試験やその場観察を活用した金属 の塑性変形に関する研究も行っている.

\*\*\*\*

# 新技術・新製品

# リマニュファクチャリングのための 浸炭部品の損傷評価手法

金澤智尚<sup>\*</sup>」 吉本光宏<sup>\*</sup>」 ヴィニャス・ダン<sup>\*</sup>2) ベルトラン・ダニーロ<sup>\*</sup>2) 田原佑規<sup>\*</sup>1 畑 典仁<sup>\*</sup>3 菅原道雄<sup>\*</sup>4 早川正夫<sup>\*\*</sup>

#### 1. 評価手法開発の背景

環境に配慮した循環型社会への貢献は,産業界においても 喫緊の課題として多種多様な取り組みが行われている.

その様な中で、リユースに分類されるリマニュファクチャ リング(再生)は、サブパーツの再利用によって省資源効果に 優れると同時に、他の資源循環手段と比較しても高い経済性 を有することから、経済と環境の両立を可能とする手段とし て、世界的な注目を集めている<sup>(1)</sup>.

近年において再生産業は,航空機,自動車部品,建設・鉱 山機械の順に市場が拡大傾向にある.中でも,建設・鉱山機 械の分野では,車体が長時間稼働となることからも,定期メ ンテナンスが重要となり休車時間やコスト低減が顧客の関心 事となっている.その上で,現地調達が容易で新品よりも安 価な再生品は,部品交換で済むことから短時間の休車となる ために需要が高い.しかしながら,再生品の中でも原動機や 減速機などに多用される浸炭部品の歯車やベアリングは,目 視判定や寸法測定のみでの再利用判定に留まり,外観で無損 傷の状態でも,リスクの回避を優先し,再利用化が進んでい ない.

そのため、日立建機㈱と物質・材料研究機構(NIMS)は、 要素試験と市場回収済みの歯車から採取した試験片に対し、 機械的・組織的な変化を破壊・非破壊の両面から捉えること で、浸炭部品の定量的な損傷評価手法を開発した。

\* 日立建機株式会社;1)主任,技師,2)一般,3)部長代理, 4)事業部長

\*\* 国立研究開発法人物質・材料研究機構; グループリーダー Damage Evaluation of Carburizing Gear for Remanufacturing; Tomohisa Kanazawa\*, Mitsuhiro Yoshimoto\*, Dan Vinas\*, Danilo Beltran\*, Yuuki Tahara\*, Norihito Hata\*, Michio Sugawara\* and Masao Hayakawa\*\*(\*Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. \*\*National Institute for Materials Science)

2021年10月28日受理[doi:10.2320/materia.61.106]

### 2. 評価手法開発のコンセプト

先行文献では、要素試験後の機械的性質や組織変化を評価 するものであり、負荷履歴が不明である稼働機械から回収し た部品の損傷評価に直接適用することは困難である。例え ば、要素試験片に対しては、X線回折法(XRD法)が先行し ており、XRD法と渦流探傷測定の非破壊検査を主として、 疲労損傷が増加するにしたがい、残留オーステナイト相 (yR)が減少した例や、電圧との相関性を示した事例があ る.また、負荷回数と残留応力(σx)の相関関係から余寿命 の予測式を提案されている.他には、X線回折ピークの半 価幅が減少する傾向を見出されている<sup>(2)-(5)</sup>.

そこで本評価手法では,図1の通り,ローラピッチング試 験片および稼働中の機体より回収した歯車を破壊・非破壊手 法にて相対比較しながら,評価を行った.試験条件は表1の 通りであり,表層・断面組織の観察をマイクロスコープと走 査型電子顕微鏡(SEM)にて行い,非破壊検査手法として, XRD(cosα法)を用いた.本手法では,損傷プロセスを機械 的性質・組織的変化と関連付けることによって,市場回収さ れた浸炭部品の再利用判定に科学的根拠を示すものである.



表1 ローラピッチング試験条件.

| No. | 負荷,<br><i>P /</i> kN | 面圧, SP / GPa | すべり率, Sr (%) | 試験オイル  | 流量,<br><i>F</i> r / (ml/min) | 温度.,<br>T/℃ |
|-----|----------------------|--------------|--------------|--------|------------------------------|-------------|
| 1   | 1                    | 2.0          | 20           | CI 400 | 200 450                      | 00 L E      |
| 2   | 6                    | 3.7          | 50           | GL490  | 300-450                      | 00±5        |

# 3. 損傷評価手法の提言

#### (1) 表層·断面組織の評価

ローラピッチング試験前後の表層状態を図2に示す. 試験 前(a)と同様に面圧2.0 GPa( $6.4 \times 10^4$  サイクル,  $1.3 \times 10^6$  サ イクル)の(b)と(c)には,明瞭なクラックは認められなかっ た.面圧3.7 GPa( $2.6 \times 10^5$  サイクル)の(d)では,摺動面に 明瞭なクラックが認められ, (e)ではピッチング損傷が顕在 化した.稼働前の歯車(f)は,試験前材(a)と同様の形態を呈 しており,稼動後の歯車表層(g)には擦れた痕跡があるもの の明瞭なクラックやピッチングは認められなかった.したが って,表層形態のみでは,微視的な損傷挙動の変化を捉えら れないと言える.

次に,表層断面の SEM 像を図3に示す. 試験前材(a) で は、マルテンサイト相の中に単一なコントラストを有する  $\gamma$ R(白矢印)が認められる. 稼働後の歯車(b)は、微細な $\gamma$ R は見られるものの、幅 $2 \mu$ m を超える粗大な $\gamma$ R が消失して いる. ピッチング損傷材の表層断面(c)では、微細な $\gamma$ R が 消失した.

図4は γR の粒子面積のヒストグラムであり,図3の組織 観察を反映している. 試験前材では γR の平均面積0.74



図2 ローラピッチング試験片と歯車の表層面の経時変化.



図3 浸炭処理の断面組織のSEM 像-焼き戻しマルテンサイ ト相と残留オーステナイト相(白矢印).

 $\mu m^2$ , 面積率( $\gamma R$  の粒子面積の総和÷視野面積)は25%であったが,稼働後の歯車では平均面積0.56  $\mu m^2$ , 面積率14%と減少した. ピッチング損傷材では,平均面積0.59  $\mu m^2$ , 面積率5%であり,負荷に伴い $\gamma R$ の個数,粒子面積,面積率が減少した.  $\gamma R$ の面積率の関しては,XRDによる非破壊検査でもほぼ同様の傾向が得られており,損傷プロセスを反映していると考えられる.

#### (2) 損傷評価手法

XRD 法により得られる σx 比と pR 比の関係から歯車の損 傷評価の検討を試みる. 図5の通り,無損傷の領域 A では, pR 比の減少に伴って σx 比が増加する傾向があり,本領域 では,表層面の観察結果 [図2(b),(c),(g)] からも,マイク ロクラックは形成されていない.したがって,従来であれば 目視判定や寸法測定のみで再利用可能と判定している歯車に 対し, pR 比と σx 比の数値からも,より信頼性の高い評価 が可能となる.

一方で,損傷を伴う領域 B では,図2(d)の様なピッチン グ部以外の摺動面においても, pR 比と σx 比が全面に渡っ て著しく減少しており,摺動疲労に伴う微視的な変化も捉え られていると想定される.よって,目視判定などの簡易評価 では判定が困難な歯車でも, pR 比と σx 比の数値により再 利用不可能との判定が,高い精度で可能となる.







図5 損傷評価における残留応力比と残留オーステナイト比の 関係.

すなわち,損傷評価の信頼性向上には,目視評価および寸 法測定以外に,本手法での評価結果ならびに組織形態を系統 的にまとめたデータベース化(DB)が必要となる.しかし実 用上は,再利用判定時に破壊検査が出来ないことから,DB の情報に基づき,浸炭部品表層部に対して,yR比とσx比 の低下域を再利用可否の評価基準とすることが求められる. 以上により,従来手法よりも機械的・組織的な観点を考慮し た形で,信頼性の高い損傷評価が,浸炭部品に対して実現可 能と期待される.

#### 4. 実用化と今後について

本技術は,特開2021-103088の通り知財として出願公開さ れており,日本金属学会誌にも本技術の一部内容が,技術論 文として掲載されている<sup>(6)(7)</sup>.加えて,2021年5月には, 日立建機㈱とNIMSの共同プレスリリースとして公表さ れ,日本経済新聞社や日刊工業新聞社などの主要メディアに て掲載されている<sup>(8)(9)</sup>.

実用面では、日立建機㈱において2021年度5月より日本 国内の拠点にて本手法の導入を開始しており、図6の通り、 AI 技術も活用した機能向上の検証も進めている.

これまでの実績では、本手法の導入以前で100%スクラッ プとしていた歯車が、導入後はスクラップ率70%と改善さ れ、約3割の歯車が再利用可能となっている.再利用可能 な部品の増加に伴い、環境面においても貢献している.

今後、本手法が日立建機㈱の主要拠点で活用され始める と、国内拠点での上述したスクラップ率の実績から鉄のスク ラップ量は、約30(ton/年)低減されると試算している.また、 Life-Cycle Assessment 手法に基づいた鉱山機械一台のライ フサイクル(LC)当たりの歯車部品の二酸化炭素の排出量 は、図7の通り約14(ton-CO<sub>2</sub>/LC)と試算されており、本手 法の展開によって、カーボンニュートラルの実現にも大きく 寄与することが期待される<sup>(10)</sup>.





図7 鉱山機械1台のLC当たりの歯車部品のCO2排出量.

#### 5. 今後の展開

リマニュファクチャリングは,新しい産業であることも影響し,研究開発事例の報告件数は,他産業と比較し少ない. しかしながら,今後の循環型社会の形成において,重要産業の一つとされている<sup>(11)</sup>.したがって,研究開発がより活発になると予想される中で,本事例の再利用判定技術は,先駆的な開発事例となり,歯車の他にベアリングなどの部品にも展開が可能と考えられる.他にも,溶接部位の余寿命診断などにも応用の可能性があり用途は広く,具体的な産業への展開に関しては,航空・宇宙分野のエンジン,プラントの高圧配管,自動車のトランスミッションなどへの技術転用も期待される.

#### 文 献

- (1) 松本光崇, 土屋哲男, 板垣宏知:エレクトロニクス実装学会 誌, 24(2021), 1-7.
- (2)野村 剛,大平隆昌,三田村宣晶,名取理嗣,植田 徹,上 光一郎,馬上英信:国際特許WO 2011/074654, (2011),1-35.
- (3) T. Kanazawa, M. Hayakawa, D. Beltran, M. Yoshimoto, K. Saito, Y. Maruyama, M. Uchiyama and T. Sasaki: Mater. Trans, 62(2021), 135–138.
- (4) 嘉村直哉,藤田 工,佐々木敏彦:材料,67(2018),694-699.
- (5) 吉崎正敏, 川原正明:日本機械学会誌, 85(2019), 1-16.
- (6)金澤智尚,吉本光宏,畑 典仁,早川正夫,目黒 奨,廣戸 孝信,松下能孝:特開2021-103088, (2021), 1-19.
- (7)金澤智尚,早川正夫,田原佑規,畑 典仁,吉本光宏,目黒 奨,廣戸孝信,松下能孝,菅原道雄:日本金属学会誌,85 (2021),198-206.
- (8) https://www.hitachicm.com/global/jp/news-list\_jp/ 21-05-20j/, (2021.09.24参照)
- (9) https: / / www.nikkei.com / article / DGXLRSP610704 \_ Q1A520C2000000/, (2021.09.24参照)
- (10) 金澤智尚,松本光崇,吉本光宏,菅原道雄,吉村彰大,松野 泰也:日本 LCA 学会誌, 17 (2021), 124–135.
- (11) 梅田 靖:サーキュラーエコノミー,勁草書房,初版
   (2021), 5-8, 26.

# 新技術・新製品

# 深紫外ピコ秒レーザーによる軟磁性材の アブレーション加工

河野健太\*1 丸山裕樹\*1 折井庸亮\*3

#### 1. はじめに

#### (1) 背 景

近年、省エネルギー化はますます重要になっており、中で も世界中の発電所で発電した電力量の過半数を消費している と言われているモータ,変圧器,リアクトルなどの電気機器 は更なる高効率化に向けた研究開発が取り組まれている. モ ータをはじめとする電気機器は電磁鋼鈑などの軟磁性の金属 材料が鉄心に用いられ磁気回路が構成されている. 一般に鉄 心の形成には薄い軟磁性材料の打ち抜き加工が用いられてお り、試作検討や少量生産においては、ワイヤ放電加工やレー ザー加工による軟磁性材の切断加工が用いられている. レー ザー加工は試作検討や少量生産の場面において, CAD デー タを変更するだけで加工形状が容易に変更でき、加工精度も 高いといった様々なメリットがある.しかし,高効率化が求 められている電気機器の鉄心の形成において、レーザー加工 は致命的ともいえる欠点があることが知られている. それは レーザー光により、材料が加熱されることによって生じる鉄 心の鉄損増加である(1).一般に、レーザー加工では材料を加 熱し溶融させるため、加工部周辺に熱の影響が残り、鉄心の 磁気特性が劣化する. そのため, 鉄心の形成にレーザー加工 を用いると、電気機器のエネルギー効率が大きく低下してし まう. そのため, 高効率化が望まれる電気機器の鉄心の形成 にはワイヤ放電加工が用いられることが多い.

#### (2) 深紫外ピコ秒レーザー加工の原理

近年、従来の溶融を伴うレーザー加工とは異なるメカニズ

Ablation Processing on Electric Steel Sheets by DUV Picosecond Laser; Kenta Kohno, Yuki Maruyama and Yosuke Orii, (Spectronix Corporation) kohno@spectronix.co.jp

2021年10月30日受理[doi:10.2320/materia.61.109]



 図1 レーザーのパルス幅による溶融加工とアブレーション 加工の違い.
 (a) ナノ秒レーザーで熱的に溶融切断したポリイミド フィルム断面
 (b) ピコ秒レーザーでアブレーション加工したポリイ ミドフィルム断面

ムである超短パルスレーザーを用いたアブレーション加工の 産業応用が進んできた.これは光のパルス幅がピコ秒(ピコ 秒は10のマイナス12乗)オーダーの非常に短い時間幅のパル スレーザーを用いることによって,瞬間的に材料を蒸発・昇 華させる加工方法である.この技術を用いるとレーザー光が 材料に照射されてから加工部周囲にエネルギーが熱として拡 散しはじめる時間(数10ピコ秒)より先にレーザー加工が完 了するため,加工部周辺への熱の影響が非常に少なく,高品 質な加工が実現できる(図1).ナノ秒レーザーでは加工部周 囲に熱が拡散するため樹脂が溶けているが,ピコ秒レーザー では加工部周囲に熱の拡散がないため断面が非常に平坦であ る.今回,電磁鋼鈑に対して,深紫外ピコ秒レーザーによる 切断検証を行い,その優位性を確認したので報告する.

#### 2. 深紫外ピコ秒レーザー

当社(スペクトロニクス)では独自なレーザー技術による国 産ピコ秒パルスレーザーを開発し事業を展開してきた.特 に,世界でも唯一当社が商品化に成功している波長が深紫外 領域(波長 266 nm)のピコ秒レーザーは2013年に発表後<sup>(2)</sup>, 産業用途に高出力化,高品質化,長期安定動作への改良を進 めてきた<sup>(3)</sup>.深紫外ピコ秒レーザーはパルス幅が短く,非熱

 <sup>\*</sup> スペクトロニクス株式会社;1)研究開発 Gr. 研究開発 Tm. リ ーダー 2)営業 Gr. ソリューション Tm. 3)研究開発 Gr. マネ ージャー



図2 商品化が完了した深紫外ピコ秒レーザー. (スペック:波長 266 nm,パルス幅 15 ps,平均出力8 W@200 kHz)

的加工が行えるだけでなく,波長が短いことによる利点があ り,従来の可視・近赤外レーザーが苦手としていたガラスや 樹脂などの透明材料や,金属材料などの高反射材料も効率よ く加工することができる.従来,産業用途で用いられてきた 深紫外光を発生するエキシマレーザーは装置が大型であり, メンテナンス等のランニングコストも大きかったが,深紫外 ピコ秒レーザーはテーブルトップサイズであり,特殊な定期 メンテナンスも一切不要である(図2).

近年,レーザーによる金属の切断加工では,出力が数 kW 級のファイバーレーザーの応用が進んでおり,厚さが数 10 mm 程度の金属材料に対しての高速切断技術が取り組まれて いる.このような比較的厚い鉄板等の切断に対しては,残念 ながら当社のピコ秒レーザーの出力はまだまだ不十分であ る.一方で,幸いにも電磁鋼鈑をはじめとする軟磁性金属材 料は低鉄損化に向けた薄帯化が進んできており,厚さが 100 um を切るような非常に薄い材料が電気機器へ利用されはじ めている.そのため,薄いガラスやセラミックプレートの微 細加工を行っていた既存のレーザー微細加工用設備とのサイ ズ的な親和性が良く,加工に必要となるレーザーの出力も小 さく済むため,アブレーション加工の早期適応が期待できる.

#### 3. 電磁鋼鈑の切断検証

深紫外ピコ秒レーザーによる切断実証のため、一般的にモ ータの鉄心の切断加工に用いられるワイヤ放電加工、CO<sub>2</sub> レーザー加工、そして、深紫外ピコ秒レーザー加工による切 断の比較を行った.材料は一般的なモータに用いられている 0.35 mm 厚さの無方向性電磁鋼鈑35A360を選定した.な お、磁気特性測定には幅 10 mm、長さ 60 mmの試料を用 い、測定は励磁周数数 50 Hz、磁束密度 0.1~1.5 T で行っ た.

#### (1) 切断部の性状

切断部の性状は図3の通りとなった.ワイヤ放電加工では、サンプルを加工液中で加工するため、経時的な酸化の影響で断面にわずかに錆が生じていることが分かる.CO2レーザーでの切断では、バリが発生している上、加工部周辺への熱の影響による変色が確認できる.一方、深紫外ピコ秒レーザーを用いた場合では、加工部周辺にバリや熱による変色がない高品位な切断加工が行えている上、切断面に金属光沢が残っており、酸化等の影響が少ないことが分かる.また、ワイヤ放電加工、CO2レーザー加工を用いる場合、材料を切断する際にスタート穴を用意する必要があるが、深紫外ピコ秒レーザーでの加工では、スタート穴が不要であるなど、加工品質以外での面でのメリットも大きい.

#### (2) 磁気特性測定

磁気特性を測定して得られた結果を得た図4に示す.



図3 切断方法による切断部の性状の違い.(ワイヤ放電加工で切断したサンプルの表面(a)と断面(d). CO<sub>2</sub>レーザー加工で切 断したサンプルの表面(b)と断面(e). 深紫外ピコ秒レーザーで切断したサンプルの表面(c)と断面(f).)



CO<sub>2</sub>レーザーによる切断加工では、ワイヤ放電加工に比 べて鉄損が大きいことが分かる.これは先行研究で報告され ている通りの傾向である.一方で、深紫外ピコ秒レーザーを 用いた切断では、ワイヤ放電加工と同等の鉄損量であり、レ ーザー照射による材料への熱の影響が大幅に低減されている ことが分かる.この結果から深紫外ピコ秒レーザーを用いて 切断することにより、従来のレーザーを用いた熱的な溶融に よる加工ではなく、アブレーション加工が行えていると判断 できる.筆者の知る限り、超短パルスレーザーによる軟磁性 材料へのアブレーション加工を磁気特性の計測による効果確 認を含めて報告された例は本報告が初めてである.

#### 4. 現在までの実績・特許

深紫外ピコ秒レーザーでの金属へのアブレーション加工は 既に複数のユーザによって,超硬合金製金型など加工が困難 な材料への適用が検討されており,今回報告した軟磁性材料 の加工に対してもすでに電気機器への利用検討が始まってい る.深紫外ピコ秒レーザーに関しては,国内特許第6571943 号,国内特許第6903325号を取得している.

# 5. ま と め

従来,レーザーを用いて軟磁性材料を切断すると加工部の 熱による磁気特性の悪化(鉄損増加)が課題となっていたが, 深紫外短パルスレーザーによるアブレーション加工を適応す ることで切断による磁気特性の劣化を低減できることを確認 した.近い将来に試作検討や少量生産の場面で,深紫外ピコ 秒レーザーをはじめとした超短パルスレーザーによる軟磁性 体への非熱的加工の適応が進むと考えている.比較的新しい 概念である超短パルスレーザーによる加工が電気機器へ応用 されることで,従来の加工工法の制約に縛られない形状の機 器の発展や打ち抜き加工が困難であったナノ結晶軟磁性体な どの応用が進み,更なる省エネルギー社会の実現が進展する ことが期待される.

#### 6. 謝辞

本研究に用いた深紫外ピコ秒レーザーは国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業と して開発された.また,検証にあたり磁気特性の評価にご協 力頂きました大分県産業科学技術センター様に厚く御礼申し 上げます.

#### 文 献

- (1) 幟立祐希,佐藤 尊,戸高 孝,下地広泰:電気学会全国大 会,(2020).
- (2) Y. Orii, Y. Takushima, M. Yamagaki, A. Higashitani, S. Matsubara, S. Murayama, T. Manabe, I. Utsumi, D. Okuyama and G. Okada: Tech. Digest of CLEO (2013), paper JTh2A. 64.
- (3) K. Kohno, Y. Orii, H. Sawada, D. Okuyama, K. Shibuya, S. Shimizu, M. Yoshimura, Y. Mori, J. Nishimae and G. Okada: Opt. Lett., 45(2020), 2351–2354.





文責:東京海洋大学 盛田元彰

(2021年10月訪問)

## 1. 技術を体で楽しむ科学館

私が皇居近くの科学技術館を訪ねたのは、長い緊急事態宣 言・まん延防止等重点措置が解除されたばかりの2021年10 月の初旬であった.多くの小学生が待ち焦がれた校外学習を 楽しんでいた.最近では、いずれの科学館においても体験型 の展示が増えているが<sup>(1)</sup>、科学技術館では、ほとんどの展示 が体を動かして手や耳、目といった五感で工学を感じられる ものであった.ゆえに文章だけでは、その魅力を十分に伝え られないが、著者なりに理科が不得意な人にも足を運んでも らえるような内容になるよう努めた.

いつでも体験できる展示物のほか,実験ショーも多く実施 されている(例えば図1). 是非,皆さんにも訪れてもらいた い.科学技術館の規模はかなり大きく,公式サイトでもバー チャル見学ができるため,事前に現地の様子を見られる.

# 2. 鉄を体で体験する「鉄の丸公園一丁目」

日本には鉄に出会えるミュージアムとして,岩手県釜石市 の鉄の歴史館,兵庫県神戸市の灘浜サイエンススクエア,千 葉県市川市の現代産業科学館<sup>(2)</sup>,そして本稿で取り上げてい る科学技術館がある.また,島根県には鉄の道文化圏に和鋼 博物館<sup>(3)</sup>のほか7つの博物館がある.科学技術館の特徴 は,遊びを通して生活の回りで鉄がどのように活躍している かを体験して学べる.科学技術館の4階にある「鉄の丸公 園一丁目」と名付けられた展示室はまさに名前の通り公園の ようなスペースであった.例えば,鉄のバネ特性を活かした シューティングゲームや,高硬度や加工性を活かしたベアリ ングカーリングゲーム,鉄が奏でる音に注目したスティール パンがある.スティールパンとはトリニダード・トバゴ発祥 のドラム缶から作られた打楽器である.このように鉄という 素材に興味を持つきっかけとなる仕掛けが多くなされてい る.入口すぐそばにあるシアター設備は,タイムマシンをか たどっており,部品として鋼線,棒鋼,鋼板等から成る実際 の鉄鋼製品が貼り付けられている.鉄の見た目の良さが活か されており,これから鉄鋼を勉強したいと興味をもっている 人や専門とする方も面白いと感じるだろう(図2).「鉄の丸



図2 鉄の丸公園一丁目の外観写真.



図1 実験スタジアム:【「ろ過」で地球の水について考えよう】の実験ショーは毎日行われている. 日曜・祝日には【レモンのチ カラ】のショーも開催される. 整理券が必要である.

公園一丁目」でも実験・工作教室があり、工作は「鉄板を使 って昆虫を作ろう」、「エッチングでステンレス鋼板に絵を描 こう」、「鋳造でオリジナルメダルをつくろう」という鉄や金 属の特徴を使ったプログラムで開催されている.エッチング とは酸で金属表面を溶かす表面処理のことである。例えば、 エッチングをすることで光沢のある金属表面はくすんだよう な様相になる.表面をマスクキングし、マスキングされてい ない部分をエッチングすることで絵を描ける.鋳造とは、目 的とする型を作製し、その中に高温で溶かした金属を流し込 み、冷やして固めることで型の形状へと金属を成形する手法 である.鋳造は鍋や水道、自動車・鉄道・航空機などの輸送 機器や電化製品等、例を挙げればきりがないほど採用されて いる.大変重要な工業技術であり、それらを工作として体験 できる場所は貴重である.開催については公式サイトにて確 認して体験して頂きたい.

# 3. 環境に配慮した鉄づくり:なぜ薄くて強い鉄を作るのか?

自動車の車体に使用される鉄は,より強く進化してきた. これは強い鉄を作れば,同じ強さに耐えるために必要な厚み が薄くすむため,安全性を保ちつつ車体を軽量化できるから



図3 自動車用鋼板の厚みの差による重さの差.

である.結果として,鉄の進化は二酸化炭素の排出量の減少 に貢献してきた.しかし,実際にどの程度軽くなったかを感 じることはなかなかできない.この「鉄の丸公園一丁目」で は1975年式の鉄製のボンネットと2000年式の鉄製のボンネ ットが置かれており,ロープを引いて重さを体験できる展示 がある(図3).たった0.2 mmの差であるが1975年のボンネ ットは本当に重かった.著者は体験したことで車体を軽量化 することによってどれくらい燃費が向上したのかについて興 味が湧き,調べてみると少し昔のデータではあるが,ガソリ ン車では車体重量1トンから1.5トンの範囲において100 kg 軽くなることで,燃費が約1 km/L 程度改善するようだ<sup>(4)</sup>. 2021年3月末現在8200万台の車が日本にはあることを考え ると<sup>(5)</sup>,鉄の高強度化はものすごく環境に貢献している.

# □字科学館で見つけた金属材料! "分別された鉄,アルミ,銅"

科学技術館では車をシュレッダーにかけた後に採取された 鉄鋼,アルミ,鋼が展示されていた(図4).今,私たちには 資源循環を考えた取組が求められており,材料を利用する際 には常にリユース・リサイクルを念頭に入れた設計が,より 要求されるようになるだろう.鉄鋼やアルミニウムは今でも 優れたリサイクル性があるが,スクラップのリサイクル過程 で混入する不純物の影響で一部の用途に限られてしまうこと が問題である.そのため,材料特性を向上させ用途を広げる 資源循環技術の研究開発を進める必要がある<sup>(6)</sup>.また,現在 では採算の合わない素材は再利用されていないが,リサイク ルする過程を効率化することで,より多くの素材をリサイク ル可能とすることが,将来技術として期待されている<sup>(7)</sup>.

### 文 献

- (1) 梅津理恵:まてりあ, 60(2021), 362-362.
- (2) 盛田元彰:まてりあ, 59(2020), 326-327.
- (3) 小村滴水:まてりあ, 59(2020), 542-543.
- (4) 中村 守: 産総研 TODAY, 6-1(2006), 16-17.
- (5) "自動車保有台数(昭和41年からの推移)".一般財団法人自動 車検査登録情報協会 HP, https://www.airia.or.jp/publish/



図4 車のリサイクルの流れを示したパネル展示と展示内の鉄スクラップ:同じ展示室内には実際のトラック,車,バイク等の運転を体験できる展示もある.

statistics/number.html, (accessed 2021–10–19).

- (6) 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略,
   (2021), 112-113, https://www.meti.go.jp/policy/energy\_ environment/global\_warming/ggs/pdf/green\_honbun.pdf,
   (accessed 2021-10-19).
- (7)伊東賢宏:NEDO2020年度成果報告会"資源循環社会実現に向けた取組",(2020),2, https://www.nedo.go.jp/content/100932829.pdf,(accessed 2021-10-19).



科学技術館外観.

科学技術館へのアクセス

\*東京メトロ

東西線:T-08「竹橋」駅下車(1b出口) 徒歩約550 m
 T-07「九段下」駅下車(2番出口) 徒歩約800 m
 半蔵門線:Z-06「九段下」駅下車(2番出口) 徒歩約800 m
 鉄新宿線:S-05「九段下」駅下車(2番出口) 徒歩約800 m



(2021年10月26日受理)[doi:10.2320/materia.61.112] (〒102-0091 東京都江東区越中島 2-1-6 http://www.jsf.or.jp/index.php)



# 本会記事

| 会 告   | 2022年春期講演大会開催方法変更のお知らせ115<br>2022年春期(第170回)講演大会ご案内ならびに参加申込みにつ |
|-------|---|
|       | いて  |
|       | 2022年春期講演大会ホームページ・バナー・各種広告募集                                  |
|       |   |
|       | 2022年秋期講演大会公募・企画シンポジウムテーマ募集                                   |
|       |   |
|       | 各種賞(村上記念賞・村上奨励賞・奨励賞・論文賞・まてりあ賞)                                |
|       | 候補者推薦募集   |
|       | 第3回日本金属学会フロンティア研究助成募集120                                      |
|       | 会誌編集委員会からのお知らせ  |
|       | 欧文誌編集委員会からのお知らせ121  |
|       | 研究集会  |
|       |   |
| 企業求人  | 青報123 まてりあ次号予告126   |
| 揭示板 … |   |
| 会誌・欧江 | 文誌2号目次125 行事カレンダー128  |

| 事務局  | 涉外 · 国際関係 : secgnl@jim.or.jp        |
|------|-------------------------------------|
|      | 会員サービス全般: account@jim.or.jp         |
|      | 会費·各種支払:member@jim.or.jp            |
|      | 刊行物申込み: ordering@jim.or.jp          |
| セミナ- | -シンポジウム参加申込み: meeting@jim.or.jp     |
|      | 講演大会:annualm@jim.or.jp              |
|      | 総務・各種賞:gaffair@jim.or.jp            |
| 学術   | <b>テ情報サービス全般</b> : secgnl@jim.or.jp |
|      | 調 査 · 研 究:stevent@jim.or.jp         |
|      | まてりあ · 広告:materia@jim.or.jp         |
|      | 会誌 · 欧文誌 : editjt@jim.or.jp         |

・投稿規程・出版案内・入会申込はホームページをご利用下さい.

会告(ホームページもご参照下さい)

# 2022年春期講演大会開催方法変更のお知らせ

2022年春期講演大会は,新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し,参加者の皆様の安全のため オンライン開催に変更いたします.皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます.

講演大会委員会委員長 御手洗容子

# 2022年春期(第170回)講演大会ご案内ならびに参加申込みについて

春期講演大会は、3月15日(火)から17日(木)までオンライン(Zoom)にて開催いたします.ポスターセッションおよび高校 生・高専学生ポスターセッションはオンライン開催にて3月22日(火)に開催いたします.

尚,参加申込みは,すべてインターネット申込となります.詳細は,下記申込要領をご覧下さい.

|  | 日日日                         |            |  |
|--|-----------------------------|------------|--|
| 日時   | 行                           | 事          |  |
| 3月15日(火)<br>9:50~10:40<br>10:50~11:40<br>13:00~17:00 | 学会賞記念講演<br>本多記念講演<br>学術講演   |            |  |
| 3月16日(水)<br>9:00~17:00                               | 学術講演                        |            |  |
| 3月17日(木)<br>9:00~17:00                               | 学術講演会                       |            |  |
| 3月22日(火)   | ポスターセッション(オンライン             | )          |  |
|  | 局 役生・ 局 専 学 生 ホ ス タ ー セ ッ シ | /ョン(オンライン) |  |

#### 《2022年春期講演大会 開催予定の各種シンポジウム》

公募シンポジウム9テーマ

- S1 プラストンの材料科学 K
- S2 ハイエントロピー合金の材料科学 WI
- S3 エネルギー関連材料の特性評価・解析・予測(Ⅱ)
- S4 材料機能特性のアーキテクチャー構築シンポジウムⅢ
- S5 特異反応場における時間/空間応答を利用した新奇材料構造創成
- S6 生体用金属・セラミックス系材料の実用化に向けた評価方法開発・標準化
- S7 永久磁石開発の元素戦略9 一次世代新材料に向けた基礎・基盤研究-
- S8 金属表面の材料化学V-めっき・耐食性・耐酸化性・触媒研究の新展開-
- S9 金属・無機・有機材料の結晶方位解析と応用技術

#### 企画シンポジウム2テーマ

#### K1 工業製品における材料選択とマルチマテリアル構造~建築構造物~

Materials selection and multi-material structure in commercial products $\sim$ architectural construction $\sim$ 

ものづくりの基盤形成を担う第8分科発案のシンポジウムで、身の回りの工業製品がどのような材料からできているか、 また材料選択やマルチマテリアル構造についてどのように考えるべきなのかを、広く議論する場を提供することを目的とす る.前回の「航空機機体」に引き続き、2回目の今回は「建築構造物」を取り上げ、建築構造材料の企業研究者だけでなく、 建築家や建築士などにも講演を依頼し、業界の動向や課題、各材料の強みや弱み、新材料の開発ならびに適用可能性について 情報提供を頂くことを計画している.これまでの講演大会にはなかった『材料を横断的に捉えるシンポジウム』として、シリ ーズ化していくことを考えている.

#### 企画責任者:

横浜国立大学教授 廣澤渉一

E-mail: hirosawa@ynu.ac.jp

共同責任者:

JFE テクノリサーチ 船川義正 金沢大 渡邊千尋 熊本大 山崎倫昭

#### K2 材料技術史から見るこれからの技術展開N-分析機器・評価装置

Future growth expected from technological history of materials IV-Analytical and evaluation instruments

金属材料技術の進展には、分析機器・評価装置の進化が欠かせない.本シンポジウムでは、多くの金属材料研究者・技術者 が使用する分析機器・評価装置を取り上げ、各装置の開発・発展に長年携わってきた先生方に、分析・評価の原理から、装置 の進化・発展の過程、最新機器・装置から得られた成果を解説していただく.そして、分析機器・評価装置の将来展望やそれ に伴う材料研究の新展開について議論する.

#### 企画責任者:

物質·材料研究機構主幹研究員 戸田佳明

E-mail: TODA.Yoshiaki@nims.go.jp

#### 共同責任者:

奈良女子大 松岡由貴 東北大 杉本 諭 東京海洋大 盛田元彰 島根大 森戸茂一

 $\diamond$   $\diamond$ 

 $\diamond$ 

#### 参加申込要領

### 「インターネットによる大会参加申込期間および URL

(事前申込)2021年11月25日~2022年2月25日

#### https://www.jim.or.jp/convention/2022spring/

#### (後期(当日)申込)2022年3月3日~3月22日

#### https://www.jim.or.jp/convention/2022spring\_after/

参加申込締切後,参加方法や講演概要ダウンロードについては,下記をご参照下さい.なお,**領収書は,決済完了後に申込** 画面から各自印刷して下さい(WEB 画面:講演大会 MyPage よりダウンロード).

#### ◆大会参加費(講演概要ダウンロード権含む)※年会費とは異なります.

参加費・懇親会の消費税扱については,ホームページ(一覧表 PDF)をご参照下さい.

| 会 員 資 格  | 事前参加申込<br>(締切日:2月25日) | 後期(当日)申込<br>(3月3日~3月22日)<br>クレジット決済のみ |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 正員・維持員会社社員,シンポジウム共催・協賛の学協会会員・鉄鋼協会会員<br>(本会非会員) | 10,000円               | 13,000円                               |
| 個人会員で <u><b>2022年3月1日時点で</b>65歳以上の方</u> *      | 無料                    | 無 料                                   |
| 学生員**  | 6,000円                | 7,000円                                |
| 非会員*** 一般                                      | 24,000円               | 27,000円                               |
| 非会員*** 学生(大学院生含む)                              | 14,000円               | 16,000円                               |

•お支払後の取消は,準備の都合上ご返金いたしかねますのでご了承下さい.

\* [65歳以上の個人会員]: 会員情報に生年月日のご登録がない場合は、課金されますのでご注意下さい. 会員情報に生年月日をご登録させて頂きますの で、大会参加登録の前に annualm@jim.or.jp まで会員番号・お名前・ご連絡先・生年月日をお知らせ下さい.

\*\* 「学生員]:卒業予定変更等により会員種別に相違がある場合,事前に会員種別の変更手続きを行ってから,大会参加をお申込下さい.

\*\*\* 非会員の参加申込者には、1年間の会員資格を付与します.ただし特典は重複して付与いたしません.

# ◆支払方法

事前申込のお支払いはクレジットカードおよびコンビニ振込決済をご利用頂けますが,後期(当日)申込はクレジット決済の <u>み</u>とさせて頂きます.また,入金後のご返金は致しかねます.事前予約申込は2月25日(金)の入金日をもって事前参加申込完 了となります.

#### ◆参加方法および講演概要の WEB 公開

講演概要の公開日は,大会2週間前の2022年3月1日(火)です. 講演大会公開サイトにログイン後,講演概要の閲覧ができます.特許関係のお手続きは,公開日までにお済ませ下さい. (事前参加申込みの方)参加申込みをされ,参加費を納入された方へは,概要公開日にオンライン参加に必要な参加者個別認 証 ID とパスワードを配信いたします.

(後期(当日)申込の方)参加申込受理通知に記載の「登録番号」および「パスワード」が講演概要閲覧に必要な個別認証 ID とパスワードになります.

#### ◆講演概要集購入について

講演概要集 DVD は作成いたしません.全講演概要は,本大会 Web サイトで公開をします.これまで概要集 DVD のみ購入をされていた方も,通常の参加登録をして頂き,概要の閲覧をお願いします.

#### ◆日本金属学会・日本鉄鋼協会講演大会相互聴講申込は実施いたしません。

参加申込 問合先

〒980-8544 仙台市青葉区一番町 1-14-32 (公社)日本金属学会 ☎ 022-223-3685 函 022-223-6312 E-mail: annualm@jim.or.jp

#### 2022年春期講演大会

# 大会ホームページ・バナー広告,大会プログラム広告(まてりあ3号付録),付設展示会(オンライン版), 誌上展示会(まてりあ5号),技術セミナー,誌上技術セミナー(まてりあ5号), 学生キャリアサポートセミナー 各募集要領

2022年3月15日(火)~17日(木),22日(火)の4日間,オンラインにて開催される春期講演大会では,各種広告,オンライン展示,各種セミナーを募集いたします.

#### ■大会ホームページ・バナー広告

- 掲載期間 2022年1月~(会期終了後もアーカイブで閲覧 できます)
- アクセス数 255,000アクセス(約2ヶ月,前回参考数値)
- サイズ タテ80ピクセル×ヨコ160ピクセル(静止画)
- データ形式 静止画の PNG(.png), JPEG(.jpg), GIF(.gif)
   リンク先アドレスも合わせてご指定下さい.
   バナーデータ(+リンク先指定)入稿後,1週間
   程度で掲載させて頂きます.
- 掲載料金 1 枠50,000円(税別)
   ※バナーデータ制作費は別途です.
   ※本会維持員様,プログラム広告掲載会社様は,50%OFF.
   ※付設展示会(オンライン版)に1枠分の掲載料金が含まれています.
   申込 随時受付致します.
- 申込最終締切 2月17日(木)

#### ■講演大会プログラム広告(冊子)

- 発行予定日 3月1日(火) まてりあ3号付録
- 原稿サイズ A4 1頁 天地260 mm×左右180 mm 1/2頁 天地125 mm×左右180 mm
- 入稿形態 完全データ(グレースケール)
- 掲載料金 後付モノクロ1頁 ¥70,000(税別) 後付モノクロ1/2頁 ¥40,000(税別) ※付設展示会(オンライン版)出展社様は,50% OFF. ※広告データ制作費は別途です.
- 申込締切 <u>1月31日(月)</u>
- 広告データ締切 <u>2月7日(月)</u>

#### ■付設展示会(オンライン版)

研究開発用機器,書籍,ソフトウェア等の出展(掲載)を募集します。
1コマの内容 社名,連絡先,URL,展示内容(展示製品, PRポイント,動画リンク,等),等
掲載期間 2月中旬~3月22日(火)
展示料金 1コマ ¥90,000(税別) ※バナー広告1枠と誌上展示会1枠(まてりあ5)

号)とのセット料金 申込・原稿締切 2月4日(金)

#### ■まてりあ5号・誌上展示会

オンライン展示会のフォローアップ広告を募集します.

発行予定日 5月1日(日)

掲載料金 1枠(1/4頁) ¥28,000(税別)

※付設展示会(オンライン版)に1枠分の掲載料
 金が含まれています.
 ※本広告企画は,付設展示会(オンライン版)に出

展されていない企業様も出稿できます.

- 申込締切 <u>3月31日(木)</u>
- 広告原稿締切 3月31日(木)

#### ■技術セミナー(Zoom 版)

オンライン会議システムを利用した企業セミナーへの参加企 業を募集します. 開催日程 3月15日(火),16日(水),17日(木), 12:20~12:50 参加料金 1枠30分 ¥50,000(税別) ※動画版1枠無料掲載 申込締切 <u>2月10日(木)</u>

#### ■技術セミナー(動画版)

大会ホームページにセミナー動画リンク(テキスト)を掲載いします.
※動画をご準備頂き,動画サイトにアップロードして下さい.
掲載期間 随時掲載開始~3月22日(火)
掲載料金 1枠 ¥30,000(税別)
申込最終締切 2月24日(木)

### ■まてりあ5号・誌上技術セミナー

| 技術セミナーのこ | フォローアップロ | 5告を募集します.    |
|----------|----------|--------------|
| 発行予定日    | 5月1日(日)  |              |
| 掲載料金     | モノクロ1頁   | ¥100,000(税別) |
| 申込締切     | 3月31日(木) |              |
| 広告原稿締切   | 3月31日(木) |              |

#### ■学生キャリアサポートセミナー(Zoom 版)

オンライン会議システムを利用した学生向けセミナーを募集 します.本大会参加者のみならず,本会学生会員,日本鉄鋼 協会・学生会員の参加も見込まれます. 会社概要,今後の採用情報,インターンシップ募集情報,研 究開発動向等をご紹介下さい. 開催日程 3月17日(木)13:00~19:00 (各社の説明は,開催時間帯のうちの30分間) 参加料金 1枠30分 ¥50,000(税別) ※動画版1枠無料掲載 ※1社1枠まで.複数枠の申込みはできません. 申込締切 2月10日(木)

#### ■学生キャリアサポートセミナー(動画版)

大会ホームページにセミナー動画リンク(テキスト)を掲載い<br/>たします.※動画をご準備頂き,動画サイトにアップロードして下さい.掲載期間随時掲載開始~3月22日(火)掲載料金1枠 ¥30,000(税別)申込最終締切2月24日(木)

#### ■申込 · 問合先

 〒104-0061 東京都中央区銀座 7-12-4(友野本社ビル 7F) 株式会社 明報社(担当:月岡太郎 または, 営業担当者まで)
 ☎ 03-3546-1337 団 03-3546-6306
 E-mail: tsukioka@meihosha.co.jp
 URL: http://www.meihosha.co.jp

### 2022年秋期講演大会公募シンポジウムテーマ募集

#### 提案期限:2022年2月10日(木) 期日厳守

会員の研究活動一層の活性化を図ることを目的として,春 秋大会において会員からの提案テーマによるシンポジウム講 演を実施いたしており,活況を呈しております.明年の秋期 大会の公募シンポジウムテーマを募集いたします.次の要領 をご参照のうえ,活発な討論が期待できる有益なテーマを積 極的にご提案下さい.(提案様式はホームページよりダウン ロードして下さい.)

- 詳細 まてりあ60巻12号818頁またはホームページ→講演 大会→お知らせ
- 問合・照会先 E-mail: stevent@jim.or.jp
   ☎ 022-223-3685 🖾 022-223-6312
   日本金属学会講演大会委員会宛

# 提案期限:2022年2月10日(木) 期日厳守

2022年秋期講演大会企画シンポジウムテーマ募集

最新の研究や技術を発信し、多くの研究者・技術者が集い 交流する魅力ある講演大会を目指して、2017年秋期講演大 会より企画シンポジウムを実施しています.従来の公募シン ポジウムとは違い、企業の方に積極的に講演頂くため、講演 概要原稿の提出は問いません.講演発表は、一般(応募)講演 枠は設けず、依頼講演および基調講演に限定いたします.

次の要領をご参照のうえ,活発な討論が期待できる有益な テーマおよび他学会との連携企画等積極的にご提案下さい. (提案様式はホームページよりダウンロードして下さい.)

- 詳細 まてりあ60巻12号819頁またはホームページ→講演 大会→お知らせ
- 問合・照会先 E-mail: stevent@jim.or.jp
   ☎ 022-223-3685 函 022-223-6312
   日本金属学会講演大会委員会宛

# 各種賞推薦(自薦)のお願い

下記の推薦をお願いします.

#### 第19回村上記念賞 候補者推薦のお願い

- 推薦資格 本会代議員による推薦
- 推薦締切 2022年2月28日(月)
- 詳細まてりあ60巻12号809頁またはホームページ→表彰

# 第19回村上奨励賞・第32回奨励賞 候補者推薦のお願い

- 推薦資格 本会代議員1名,講演大会委員1名または正員3 名による推薦
- 推薦締切 2022年2月28日(月)
- 詳細まてりあ60巻12号809頁またはホームページ→表彰

#### 第70回論文賞・第2回新進論文賞 候補論文推薦(自薦)のお願い

- 推薦資格 本会代議員,会誌・欧文誌編集委員,当該論文の 査読者,著者本人
- 推薦締切 2022年2月28日(月)
- 詳細まてりあ60巻12号811頁またはホームページ→表彰

#### 第12回まてりあ賞 推薦(自薦)のお願い

- 推薦資格 会報編集委員または正員3名による推薦,著者 本人
- 推薦締切 2022年2月28日(月)
- 詳細まてりあ60巻12号811頁またはホームページ→表彰

# 第3回日本金属学会フロンティア研究助成募集

教育・研究機関での金属及びその関連材料分野の学術研究及び技術研究の発展や若手研究者の育成や奨励を主な目的として、金属及びその関連材料分野に関連する材料又はプロセスに関する研究に助成金を交付しますので、助成の対象となる研究 を募集いたしますので、応募下さい.

# | 募集期間:2022年3月1日(火)~4月30日(金)まで|

# 募集要項

# 1. 応募資格

応募者(代表者)は、2022年4月1日時点で45歳以下の日本の教育機関または公的研究機関に所属し、日本国内で研究に従事する者(学生・大学院生および企業との兼務者を除く)であること.ただし、共同研究者は国外でも可とする.

応募は一人一件とします.同一研究室からの複数応募は可 能ですが,新規採択は1件とする.

活動開始時には,非会員は会員になることが望ましい.

過去に助成を受けた方も,研究期間が終了していれば応募 可能.

過去に採択されなかったテーマで再応募する場合は新たに 申請書を提出する.

#### 2. 助成の対象となる研究

金属及びその関連材料分野に関連する材料又はプロセスに 関する調査,試験,研究及び開発とする.

- 研究期間:助成研究の実施期間は,原則2年間とする.研究開始日が年度途中となる場合は, 年度をまたいだ2年間とする.
- 4. 助成件数:年間10件以下
- 5. 助成金額:1件あたり,150万円以下
- 6. 助成金の使途

研究等に直接必要な費用及び所属組織の必要最低限の間接 経費に充当すること.研究者の人件費(臨時雇用の研究補助者等の費用を除く)には充当できないものとする.

#### 7. 助成金の交付方法および交付期間

研究助成金の交付方法は,原則として,助成実施者が所属 する組織に対する奨学寄付の形とする.共同研究者が別の 組織に所属する場合は,複数の組織に交付することは可能 です.

研究実施者は,速やかに助成金受領のために助成金交付の 手続き(奨学寄附受付窓口の連絡等)を行うこと.

#### 8. 応募方法

 (1)提出書類:所定様式の「研究助成金申請書」に必要事項を 記入し,提出する。
 申請書の様式は、本会のホームページからダウ

ンロードできます.

必要事項:応募者,研究題名,研究分担者(共同研究者が ある場合),予算(費目,金額),研究目的(背 景,必要性,意義,価値,成果活用の見込み 等),研究計画(実施計画,成果目標等),報告 予定,該当する分科,研究業績,金属学会で の活動実績等

#### (2)作成要領

「研究助成金申請書」に記載された作成要領に従って日本 語(専門語等で部分的に外国語を使用することは可)で作成 すること・申請書については,作成要領に明記されたペー ジ数制限(概ね4ページ程度)を遵守すること・制限ペー ジ数を超えた申請は受け付けません。

(3)提出方法

作成した研究助成金申請書を, E-mail の添付ファイルで 提出して下さい.

なお、ファイルは MS-Word 形式として下さい. FAX や 紙での申請は受け付けません.

提出書類等は,採否にかかわらず返却しません.

#### 【遵守事項】

研究助成金の交付を受ける際には,研究実施者(応募者及 び共同研究者)は,次の事項を遵守下さい.

- ①助成研究は,あらかじめ本会に提出した助成研究実施計画 に従って実施すること.
- ②助成研究の実施過程において助成研究実施計画を変更する 必要が生じた場合(中止する場合を含む)は速やかに報告 し、重大な変更については本会と対応を協議すること.
- ③助成実施者が所属している組織から別の組織に異動する場合は、本会と対応を協議すること.
- ④研究終了6ヶ月後までに、終了報告書(A4様式1枚)及び成果報告書を日本語(専門語等で部分的に外国語を使用することは可)で作成し、原則としてE-mail添付にて提出すること.なお、成果報告書は"まてりあ"への成果報告(2頁)の投稿に代えるものとする.
- ⑤本会から求められた場合は、実施状況を報告すること.ま た本会が研究施設への訪問を希望した場合は、可能な範囲 で対応すること.
- ⑥研究実施者又は研究実施者の所属する組織は、帳簿を備 え、助成研究に係わる経理を他の経理と明確に区別し、 本会から照会があった場合はこれに応ずること。
- ⑦研究成果は研究開始時から研究完了後1年までの間に本 会の講演大会における発表2件及び本会の欧文誌又は会 誌に論文を投稿すること.
- ⑧研究成果を学会・学術論文誌・新聞等に発表する場合は、 事前に本会に連絡するとともに、本会から資金援助を受けたことを明記すること。
- ⑨実施計画に記載した研究を実施しなかった場合,提出期限 後1年を経過しても研究成果報告書の提出がない場合又 は研究実施者が研究中止の申し出をした場合には,研究助 成金の全額又は残額を返還すること.

#### 【留意事項】

- 機器・設備等の帰属 助成金により取得された機器・設備等は,原則として研究 実施者の所属する組織に帰属します.
- 2. 助成研究の成果の帰属

助成研究の成果として得られた特許等の知的財産権は,原 則として研究実施者に帰属します.

3. 助成研究の成果の公表等

成果報告は、この法人の会報及びホームページ上で一般の 閲覧に供します.

4. 申請書記載情報の取り扱い

申請書に記載された研究情報については,審査・選考以外 の目的には一切使用しません. また,個人情報については,本会外へは一切漏洩しません.

5. その他留意事項

 $\Diamond$ 

- ①採否の事由は非公開とし、これに関する問い合わせにはお 答えしません。
- ②研究助成金の申請後,何らかの理由により研究を実施でき ないことが判明した場合,速やかに本会に報告すること.

問合・申請先
 申請書は下記 E-mail アドレスに提出下さい.
 2,3日過ぎても受理返信通知のない場合は、ご連絡下さい.
 (公社)日本金属学会 フロンティア研究助成係
 E-mail: stevent@jim.or.jp ☎ 022-223-3685

会誌編集委員会からのお知らせ

# 日本金属学会誌の冊子の発行につきまして

 $\Diamond$ 

 $\bigcirc$ 

#### 会誌編集委員会

日本金属学会誌は毎月1日発行としておりましたが,掲載ページ数維持のため,第86巻(2022年)は 冊子を2号ずつの合併とし,<u>偶数月1日</u>の発行といたします.なお,オンライン・ジャーナルは引き 続き毎月25日に公開いたします.

 $\diamond \qquad \diamond \qquad \diamond$ 

欧文誌編集委員会からのお知らせ

# Materials Transactions 論文フリーアクセス公開サービス(Open Choice)について

『公開後すぐに, できるだけ多くの読者に読んでもらいたい !!』というご要望に応えるため, 投稿・掲載費用に, <u>追加</u> 費用(3万円)をお支払いいただければ, 半年間の認証期間を設けることなく, 公開即フリーダウンロードを可能とする サービス(Open Choice)がございます.

是非ご利用下さい.詳細は、ホームページ:刊行物 → 欧文誌 をご参照下さい.

■Recent Research and Development in the Processing, Microstructure, and Properties of Titanium and its Alloys(チタンおよびチタン合金のプロセシング・組織・特性に関する研究・開発の最前線)

チタンに関する最大の国際会議,第15回チタン世界会 議,は2023年にスコットランドのエジンバラで開催されま す.これに合わせて航空宇宙,医療,環境などの応用分野を 念頭にチタンの低コスト化,用途拡大,高機能化などの研究 が活発化するものと思われます.日本のチタンに関しての学 術団体も設立されたところです.これまで Materials Transactions 誌では,チタン世界会議と前後してチタンおよびチ タン合金に関する特集号を2009年,2013年,2019年に発行 してきました.今回もチタン・チタン合金やチタン系金属間 化合物に関してのプロセシング,組織および特性,例えば製 精錬,積層造形法(AM),マルチマテリアル化,加工,複合 化,組織形成,相変態,力学的・化学的・物理的特性などに 関しての最新の研究・開発の成果に関しての論文を広く募集 します.

上記テーマに関する特集を, Materials Transactions 63巻12 号(2022年12月発行)に予定しております. 多数ご投稿下さ いますようお願いいたします.

掲載予定号:第63巻第12号(2022年) 原稿締切日:2022年6月1日(水)

• 投稿に際しては、日本金属学会欧文誌投稿の手引・執筆要 領(本会 Web ページ)に従うこと.

•通常の投稿論文と同様の審査過程を経て、編集委員会で採 否を決定する.

•著者は、投稿・掲載費用をご負担願います.

問合せ先 〒980-8544 仙台市青葉区一番町 1-14-32 (公社)日本金属学会欧文誌編集委員会 ☎ 022-223-3685 E-mail: sadoku@jim.or.jp https: //jim.or.jp/

| - 研究隹 今  |  |
|----------|--|
| W1207525 |  |
|          |  |

研究会 No. 75

# キンク研究会 2022年度研究会

# 「ミルフィーユ構造物質のキンク強化:実験と理論の 両面からのアプローチ」

キンク研究会は,近年注目の集まっているキンク変形とい う特異な変形挙動を題材に,回位などの新たな視点から材料 の変形と破壊についての基礎的議論を深めるとともに,キン ク導入を利用した高強度材料の開発を進め,新しい材料研究 領域の構築に展開していくことを目的として平成27年度か ら活動しています.

令和4年度キンク研究会では、マグネシウム合金をはじ めとするミルフィーユ構造物質におけるキンク強化を実験と 理論の両面から捉えた議論を行いたく、下記3名の講師の 方々から話題提供をいただき、参加者の皆様とともにキンク 強化の理解を深めたいと思います.本研究会にご参加希望の 方は、下記要領にて事前申し込み下さい.

#### 日 時 2022年3月29日(火) 13:30~17:00

- 共催 軽金属学会「LPSO/MFS 構造材料研究部会」,新学術 MFS セミナー,高性能 Mg 合金創製加工研究会,熊本大学 MRC セミナー
- **方 式 Zoom**によるオンライン開催(参加申込者へミーテ ィング ID とパスワードを後日連絡)

参加費 無料

- 申込方法 <u>3月22日(火)17:00までに、</u>事務局(藤居)まで参 加のメールを送信して下さい.
- 事務局 東京工業大学 物質理工学院

藤居俊之(E-mail: fujii.t.af@m.titech.ac.jp)

プログラム

13:30~13:35 開会挨拶 名大 君塚 肇

13:35~14:20 高次塑性加工法によるバルク材へのキン ク導入とキンク制御

物材研 染川英俊

14:20~15:05 格子欠陥がキンク強化に及ぼす影響の定 量的評価~高次勾配結晶塑性メッシュフ リー法によるアプローチ~

佐賀大 只野裕一

- 15:05~15:15 一休憩—
- 15:15~16:00
   キンク組織の変形により生じる回位と連携的変形

   東工大 稲邑朋也

   16:00~16:55
   総合討論


 掲載料金:会員:20,000円(税別)(一般:40,000円(税別))
 原稿締切・掲載号:毎月1日締切で翌月号に1回掲載.
 原稿字数:840字程度
 掲載内容:求人側の必要事項:会社概要・職種・資格・待遇・勤務地・応募方法・応募締切日・問合先・書類提出先・ホームページアドレスなど求職者の知りたい情報.
 原稿提出先:電子メール(受け取りメールの確認をして下さい) E-mail: materia@jim.or.jp

#### **ℝ**電力中央研究所

◇一般財団法人電力中央研究所 研究職 募集◇

- 事業内容 電力中央研究所は、1951年に電気事業の共同研究機関として設立されました。
   電力業界の中央研究機関として、また非営利の学術研究機関として、電気事業が直面している経営課題や、地球規模のエネルギー・資源、環境、持続的経済発展をめぐる諸問題の解決を図るべく、研究開発に取り組んでいます。
- 職 種 研究職(正職員,任期なし)
- 所属 エネルギートランスフォーメーション研究本部 材料科学研究部門
- 勤務地 神奈川県横須賀市

#### 待 遇

- ○給与等
  - 初任給 博士了294,200円 修士了240,000円
     ※前職がある場合は,経験・能力を考慮し
     当所規定により決定
  - 諸手当 時間外手当,扶養手当,通勤交通費等
  - 昇給 年1回
  - •賞与 年2回
- ○勤務形態
  - フレックスタイム制(コアタイム:11時~15時, 標準労働時間:7時間40分/日)
- ○休日・休暇
   完全週休2日制(土・日),祝日,創立記念日(11月7日),夏季・年末年始休暇 他 有給休暇(20日/年)
- 募集テーマ 「統計的特性評価に基づく構造材料の劣化モデ リング」

当所では,原子炉圧力容器鋼や原子炉内構造物用ステンレ ス鋼などの原子炉材料を対象として,化学組成や金属組織, 強度の特性分布を実験的に詳細評価するとともに,得られた 実験データの統計分析に基づく材料劣化モデリング研究に取 り組んでいます.

本募集で採用された方には、金属材料物性の統計的データ分 析に基づく材料劣化挙動のモデル化に従事頂きます.

#### 応募資格·専門分野

- ・修士または博士課程修了者(新卒・キャリアいずれも可)
- 金属組織の分析・評価,機械特性評価等の金属工学や応用物理に関する実験研究および金属材料物性の統計的データ分析の素養をお持ちで,材料劣化モデリング研究に

意欲的に取り組んで頂ける方.

- 応募方法 以下の URL より応募して下さい. https://mypage.111.i-web.jpn.com/criepi/bosyu/ career/search/detail.html?no=14
- 応募締切 通年採用(候補が決まり次第,終了)
- HPアドレス 会社 HP:https://criepi.denken.or.jp/ 採用 HP:https://recruit.denken.jp/index\_ top.html
- 問合せ先 総務グループ 採用担当 ☎ 03-3201-6601(代表) E-mail: saiyo@criepi.denken.or.jp



#### 〈公募類記事〉 無料掲載:募集人員,締切日,問合先のみ掲載. 有料掲載:1/4頁(700~800文字)程度. 「まてりあ」とホームページに掲載;15,000円+税 ホームページのみ掲載;10,000円+税 〈その他の記事〉原則として有料掲載. 原稿締切・掲載号:<u>毎月1日締切で翌月号1回掲載.</u> 原稿提出先:電子メール(受け取りメールの確認をして下さい)

E-mail : materia@jim.or.jp

#### 公募

◇東北大学金属材料研究所 原子力材料工学研究部門 助教 公募◇

公募人員助教1名(東北大学は,男女共同参画を推進しています.子育て支援の詳細等,男女共同参画の取組については下記 URL をご覧下さい.URL: http://www.bureau.tohoku.ac.jp/danjyo/)

**所 属** 東北大学金属材料研究所原子力材料工学研究部門

- **専門分野** 原子力・核融合炉等に適用可能な材料科学に関わる研究.所属部門教員と共同して意欲的に取り組んでいただける方であれば、これまでの経験は問わない.
- 応募資格 博士の学位を有する方,あるいは着任予定時期までに博士の学位を取得見込みの方
- 着任時期 決定後,できるだけ早い時期
- **勤務形態** 常勤 任期あり 7年(再任審査後最長で3年の 更新)
- 待 遇 東北大学の規定による
- 公募締切 令和4年1月31日(月) 必着
- 提出書類 (1)履歴書(写真添付)

(2)研究業績リスト((原著論文,国際会議の発表・ プロシーディング,著書,特許,競争的資金獲 得状況,論文引用度データ等),論文データベ ース個人 ID(例えば ResearcherID)があればリ ストの初めに記載)

- (3)主要論文別刷3編(コピー可)
- (4)これまでの研究概要(2,000字程度)

(5)着任後の研究計画(2,000字程度)

(6)推薦書,または照会可能者1~2名の氏名と連 絡先

- 書類送付先 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1 東北大学金属材料研究所 原子力材料工学研究部門 教授 笠田竜太
   ☎ 022-215-2065 [Ш] 022-215-2066
   E-mail: r-kasada@imr.tohoku.ac.jp
- ※応募書類の封筒表面には「原子力材料工学研究部門助教応 募書類」と朱書きし,書留にてお送り下さい.

※応募書類の返却は致しません.

※履歴書は本応募の用途に限り使用し、個人情報は正当な理 由なく第三者へ開示することは一切ありません.

◇物質・材料研究機構 若手国際研究センター ICYS リサーチフェロー公募◇

募集人員 ICYS リサーチフェロー 若干名

所 属 若手国際研究センター

- 専門分野 独自の発想に基づき,NIMSの優れた研究環境 のもと独立して様々な材料(量子材料,電池材 料,磁性材料,構造材料,データ科学,有機材 料,生体材料等)の研究に取り組む若手研究者を 募集.国内最高ランクの給与と年間200万円の研 究費を支給.NIMS 定年制研究員への応募時の 優遇措置あり(概ね5割が採用).
- 応募資格 博士学位取得後10年以内,または着任までに取 得見込みの方
- **着任時期** 2022年8月1日~2023年3月1日
- 任 期 最長3年(産休・育休制度あり)
- 提出書類 様式などの詳細は下記 URL をご参照下さい. https://www.nims.go.jp/icys/recruitment/
- 応募締切 2022年3月31日(木)必着
- 問合せ先 物質・材料研究機構 ICYS 採用担当 E-mail: icys-recruit@nims.go.jp

集会

|  | ◇レアメタル研究会◇                |
|--|---------------------------|
| ■主 催   | レアメタル研究会                  |
| ■主 宰 者   | 東京大学生産技術研究所 教授 岡部 徹       |
| ■協 ナ   | 」 (一財)生産技術研究奨励会(特別研究会 RC- |
|  | 40)                       |
| ■共 催   | 東京大学マテリアル工学セミナー           |
|  | レアメタルの環境調和型リサイクル技術の開発     |
|  | 研究会                       |
|  | 東京大学生産技術研究所 持続型エネルギー・     |
|  | 材料統合研究センター                |
|  | 東京大学生産技術研究所 非鉄金属資源循環工     |
|  | 学寄付研究部門(JX 金属寄付ユニット)      |
| ■+ <b>カ</b> <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</del> | • ( 九)叔厶尼兴人 ( 九)次派 丰丹兴人   |

■協 賛 (一社)軽金属学会, (一社)資源・素材学会,

(一社)新金属協会,(公社)日本化学会,(公社)日本金属学会,(一社)日本チタン協会,

- (一社)日本鉄鋼協会 (五十音順)
- ■開催会場 ZOOM 等で行う「リアル講演会+講演のネット配信のハイブリッド研究会」

■参加登録・問合わせ

岡部研 レアメタル研究会事務担当 宮嵜智子 (mailto: tmiya@iis.u-tokyo.ac.jp)

第100回 2022年3月11日(金)14:00~

An 棟 2F コンベンションホール

リアル講演会+講演のネット配信(Zoom Webinar & YouTube)のハイブリッド研究会

テーマ:非鉄業界における研究や教育(人材育成)に関する未 来

午後2:00~

★第100回記念講演会 非鉄分野の将来を担うホープが夢を 語る★

司会 東京大学 生産技術研究所 非鉄金属資源循環工学寄付研究
 部門 特任教授
 東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻 教授

所 千晴

- 講演(各25分+5分質疑応答)(敬称略)
- •国境を飛び越える製錬技術の面白さ、Umicore が取り組 む非鉄人材育成(仮)

Umicore, Corporate Research & Development, Associate Scientist (Recycling & Extraction Technologies) 八木良平

高効率エネルギー利用と資源循環に向けたコトづくりと人づくり(仮)

東京大学 生産技術研究所 講師 大内隆成

- 国内外環境変化と非鉄金属,そして研究者としての役割と 夢~韓国の非鉄金属分野の事例を中心として~(仮)
   Principal Researcher, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM), Associate Professor, University of Science and Technology, Korea
- ・非鉄分野における研究者としての夢とロマン(仮)
   九州大学大学院 工学研究院 材料工学部門 准教授
   谷ノ内勇樹

•希土類金属製錬学の体系化と展望(仮) 東北大学大学院 工学研究科 金属フロンティア工学専攻 准教授 竹田 修

•私が追い求めてきた夢とロマン(仮)

東京大学 生産技術研究所 教授 岡部 徹 総合討論・意見交換 モデレーター 東京大学 生産技術研究所 特任教授 黒川晴正 東京大学 生産技術研究所 シニア協力員 中村 崇 午後6:00~

研究交流会・意見交換会

\*レアメタル研究会ホームページ\* https://www.okabe.iis.u-tokyo.ac.jp/japanese/rc40\_j.html



論 文一

フラッシュ現象を利用した正方晶ジルコニア(8Y-CSZ)の微視き裂の修復

内藤楓貴 森田孝治 寺田大将

——速報論文-

ポーラスアルミニウムとアルミニウム緻密板材の発泡 中のプレス加工による接合

大塚 駿 半谷禎彦 三ツ木寛尚 天谷賢児

#### Materials Transactions 掲載論文

Vol. 63, No. 2 (2022)

-Review-

Structure and Properties of Au–Sn Lead-Free Solders in Electronic Packaging

Xi Wang, Liang Zhang and Mu-lan Li

—Regular Article——

**Microstructure of Materials** 

A New Approximate Solution for Diffusional Growth and Dissolution of Cylindrical Precipitates Akira Seki and Kotarou Hayashi

Microstructure Control of Continuous Casting Slab of Grain Oriented Silicon Steel

Jiang-bo Li, Bi-rong Deng, Xiu-zhi Yang, Liang Liang, Hai-chuan Wang and Ting Wu

Advanced Mg–Al–Ca Alloys with Combined Properties of High Thermal Conductivity, High Mechanical Strength and Non-Flammability

Yoshihito Kawamura, Kazuki Ougi, Shin-ichi Inoue, Takanori Kiguchi, Makoto Takafuji, Hirotaka Ihara and Donald S. Shih

Precipitation Behavior of Aluminum-Manganese Alloy under Different Heating Methods

Hongkai Zhang, Hao Xiao and Ke Huang

Fabrication of Textured Porous Ti3SiC2 by SlipCasting under High Magnetic Field and Micros-<br/>tructural Evolution through High TemperatureDeformationNana Hashimoto, Ken-ichi Ikeda,<br/>Seiji Miura, Koji Morita, Tohru S. Suzuki and Yoshio Sakka

Formation of Particle-Dispersed Nanocomposite and Supersaturated Solid Solution by Mechanical Alloying of Al and  $Al_2O_3$  Powders

Tatsuaki Sakamoto, Tomoharu Mizuka, Shinya Shiga and Hiromichi Takebe

#### Preferential Dynamic Grain Growth Mechanism Enabling the Control of Microstructure and Texture by High Temperature Deformation: Experimental Evidence and Applicability

Hiroshi Fukutomi, Kazuto Okayasu, Yusuke Onuki, Makoto Hasegawa, Equo Kobayashi, Bohumir Strnadel and Osamu Umezawa

**Mechanics of Materials** 

Double Steady-State Creep Behavior in Solid-Solute-Strengthened Zircaloy-4

Tetsuya Matsunaga, Hiromichi Hongo, Masaaki Tabuchi and Yoko Yamabe-Mitarai

Age-Hardening Behavior in High-Nitrogen Stable Austenitic Stainless Steel

Takuro Masumura, Tatsuya Honda, Kosuke Naridomi, Shohei Uranaka, Toshihiro Tsuchiyama, Goro Miyamoto and Shota Yamasaki

Effect of Residual Stress Distribution on the Formation, Growth and Coalescence of Voids of 27Cr White Cast Iron under Impact Loading

Quyen Hoang Thi Ngoc, Ngoc Tran Vu Diem, Viet Nguyen Hoang, Hai Nguyen Hong, Ha Le Thu and Nam Nguyen Duong

Densification Behavior and Microstructures of the Al-10%Si-0.35Mg Alloy Fabricated by Selective Laser Melting: from Experimental Observation to Machine Learning Yuta Yanase, Hajime Miyauchi, Hiroaki Matsumoto and Kozo Yokota

**Materials Chemistry** 

Thermodynamics of Oxygen in Molten Nd–Fe–BAlloy for Production of Low-Oxygen Nd–Fe–BMagnetRyota Nakazawa, Kosuke Noguchi and<br/>Yoshinao Kobayashi

Thermodynamic Property of Oxygen in Nd–Dy–OSystem for Reduction of Dy Consumption in Nd–Fe–B MagnetsRyota Nakazawa, Kosuke Noguchi<br/>and Yoshinao Kobayashi

Hydrothermal Synthesis of  $Zn_2GeO_4$  and  $Mn^{2+}$ Doped  $Zn_2GeO_4$  (ZGO) Nanoparticles with Controlled Luminescent Properties

Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Cao Xuan Thang, Nguyen Duc Trung Kien and Nguyen Viet Tung

Effect of Room Temperature Fine Particle Peening Pretreatment on Grain Refinement of Fe-Cr Alloys by AIH-FPP Shogo Takesue, Shoichi Kikuchi and Jun Komotori

#### Temperature Dependence of Solid-Liquid Interfacial Energy for Pure Metals by Metadynamics-Based Simulations

Kensho Ueno, Satoru Fukuhara and Yasushi Shibuta

#### **Materials Processing**

Evaluation of Ejection Force for Die Castings by FEM Thermal Stress Analysis with Elasto-Plastic-Creep Model

> Shoji Ueda, Shinji Sannakanishi, Hidetoshi Shiga, Muhammad Khairi Faiz and Makoto Yoshida

#### **Engineering Materials and Their Applications**

Optical, Electrical Properties and Structure of Multilayer Iron-Doped Indium–Tin Oxide Thin Films Sputtered on Preheated Glass Substrates Makoto Ohtsuka, Ruslan Sergiienko, Svitlana Petrovska and Takashi Nakamura

#### Effects of Mechanical Properties of Steels on Dynamic Collapse Behavior of High Strength Steel Hat Columns

Yoshitaka Okitsu, Shusaku Takagi, Yoshikiyo Tamai, Tadashi Naito, Kaneharu Okuda, Naoki Takaki and Tomoaki Sugiura

#### **Coining of Pierced Hole with Aid of Scrap**

Takashi Yasutomi, Shigeru Yonemura, Tohru Yoshida and Masaaki Mizumura

## Hydrogen Embrittlement Behavior of Pure Ni and Ni–20Cr Alloy with Different Grain Sizes

Naohiro Kobayashi, Motomichi Koyama, Kenji Kobayashi, Tomohiko Hojo and Eiji Akiyama

#### -Express Rapid Publication-

#### Classification of Mechanical Properties of Aluminum Foam by Machine Learning

Yoshihiko Hangai, Kenji Okada, Yuuki Tanaka, Tsutomu Matsuura, Kenji Amagai, Ryosuke Suzuki and Nobuaki Nakazawa

Analysis of Hardness Homogeneity in Pure Niobium Subjected to Equal Channel Angular Pressing Reinan T. F. dos Santos, Thamyres M. Lima and Wilton W. Batista

High-Temperature Heat-Treatment at 1673 K: Improvement of Pitting Corrosion Resistance at Inclusions of Type 304 Stainless Steel under Applied Stress Shimpei Tokuda, Izumi Muto, Yu Sugawara and Nobuyoshi Hara



◎日本金属学会誌では、新規論文の投稿を歓迎しております.
(1)投稿・掲載費用が無料、
(2)オンラインでの公開後、即時に無料で全文のダウンロードが可能、
(3)公開後2年以内であれば、欧文誌への英訳論文の投稿が可能などの利点があります。是非ご検討下さい.

 $\Diamond$  $\Diamond$  $\bigcirc$ 

まてりあ第61巻3号 予告 [金属素描] イリジウム [最近の研究] ロジウムの薄膜化による特異な機能発現と環境触 [最近の研究] 歯科臨床で利用される審美修復物 —他— 一編集の都合により変更になる場合がございます-



| ш д                     |            |                       |         |        |
|-------------------------|------------|-----------------------|---------|--------|
| 大谷誠一朗 川崎重工業株式会社         | 岸村浩明       | 防衛大学校                 | 山下享介    | 大阪大学   |
| 貝沼僚太郎 三菱商事 RtM ジャパン株式会社 | 齋藤設雄       |                       |         |        |
| 学生員                     |            |                       |         |        |
| 浅井琳太郎 新潟大学              | 尾崎奈保       | 信州大学                  | 下野祐太    | 京都大学   |
| 阿 部 泰 寛 東北大学            | 上川洸瑠       | 東北大学                  | 杉原健太    | 兵庫県立大学 |
| 江 皤 朋 陽 東北大学            | 亀谷憲嗣       | 京都工芸繊維大学              | 豊永哲也    | 大阪大学   |
| 大川諒一郎 名古屋工業大学           | 菅 野 友 貴    | 山形大学                  | 中島聡一郎   | 信州大学   |
| 小 川 紘 平 兵庫県立大学          | 北垣 翔       | 大阪府立大学                | 林 和磨    | 兵庫県立大学 |
| 小 川 達 哉 北海道大学           | 阪西龍太郎      | 名古屋工業大学               | 南 野 純 平 | 大阪府立大学 |
| 外国一般会員                  |            |                       |         |        |
| ZHAO LUO 東北大学           |            |                       |         |        |
| 外国学生会員                  |            |                       |         |        |
| 高 鍾 斌 京都大学              | 劉建坤        | 京都大学                  |         |        |
|                         |            |                       |         |        |
|                         |            |                       |         |        |
|                         |            |                       |         |        |
|                         |            |                       |         |        |
|                         | ^          | <u>^</u>              |         |        |
|                         | $\diamond$ | $\diamond$ $\diamond$ |         |        |

書評

표

#### 日本の金・銀・銅が世界を変えた~地中の宝を文明の宝に変えた技術とその歴史~

池田大亮 著

昨年の東京オリンピックで使われた金・銀・銅メダルが、日本各 地で集められた廃棄家電をリサイクルして得た金32kg,銀3,500 kg,銅2,200kgから作られたことはご存知であろう.都市鉱山を 利用すれば、日本は立派な資源国であることが証明された.

ところが、日本は古来より、金・銀・銅の「天然資源が豊かな国」 であったことを本書は語る.708年に日本で初めて流通した通貨 「和同開珎」は、武蔵国秩父で採掘された自然銅から造られたこと、 中世には陸奥国で盛んに採取された金を用いて、内外装全て総金箔 貼りの中尊寺金色堂が建立されたこと、室町時代から採掘が始まっ た岩見銀山では当時、世界の銀の3分の1を産出し、計6,000トン が輸出されたことからも、日本が金・銀・銅の一大資源国であった ことが分かる.

本書はこれらの歴史事実を羅列するだけでなく、なぜ日本で多様 な鉱物資源が形成されたか、それらの鉱物に人類(および日本人)が どのように出会い利用したか、近代以前の日本人がいかに人力で探 鉱、採鉱、選鉱、製錬を行ったかを解説していく.和同開珎を流通 させ大仏を建立できるほど、国内で銅が生産できた奈良時代から、 一転して平安時代中期から鎌倉時代には、中国の銅銭を輸入して需 要に対応せざるをえないほど、国内銅産量が激減する.この理由 を、古文書を読み解くほどの著者の豊富な知識と理系的・文系的ア プローチで、ものの見事に推測していく.さらに、銅の新たな製錬 技術が開発されたことにより、室町時代からは銅の輸出が再開でき たことを解説する部分は、本書の圧巻であろう.

著者は、趣味の鉱物採集と史跡・博物館巡りが高じて本書を執筆 した旨を記すが、本書の内容は金属学だけでなく、歴史学、地政 学、地学、地球化学、植物学、経済学…様々な学問を駆使した研究 論文と言える.著者の本職での経験に基づく「電気銅のよもやま話」 も、「まてりあ」読者に大いに参考になる.

(物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 戸田佳明) [2021年 B6 版 アグネ承風社サイエンス 114頁 2000円+税]

| 行 | 事 | カ | レ | ン | ダ | — | 太字本 |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|---|---|---|---|---|---|---|-----|

|                    | 1] 争 刀   |  | 太字本会主催(ホーム・  | ページ掲載)       |
|--------------------|--|--|--|--------------|
| 開催日                | 名称·開催地·掲載号   | 主催   | 問合先  | 締切           |
| 2022年2月            |  |  |  |              |
| $1 \sim 14$        | Mate2022 28th Symposium on "Microjoining<br>and Assembly Technology in Electronics"(Web<br>開催) | スマートプロセス<br>学会他                                      | TEL 06-6879-7568 mate@sps-mste.jp<br>http://sps-mste.jp/mate/  |              |
| 4                  | 第346回塑性加工シンポジウム「低炭素化社会への取り組み」-CO2の回収,利用,排出減-(Web開催)  | 日本塑性加工学会   | http://www.jstp.or.jp  | 定員<br>100名   |
| 14                 | 第421回講習会「放電加工と電解加工の基礎と最<br>新動向〜電気加工の最前線〜(Web 開催)   | 精密工学会  | TEL 03-5226-5191<br>https://www2.jspe.or.jp/form/koshukai/<br>koshukai_form.html                                 |              |
| 17                 | 第2回次世代高性能磁性材料研究会(Web 開催)   | 日本金属学会若手<br>研究グループ                                   | https://forms.gle/Nx91Cb79dHdTZoiQ6  |              |
| 18                 | 触媒材料の金属学研究会 第6回ミニシンポジ<br>ウム「水素吸蔵合金と金属触媒材料の融合を目指<br>して」(つくば)(1号57頁)                             | 研究会 No.78<br>触媒材料の金属学<br>研究会                         | TEL/FAX 022–217–5723<br>satoshi.kameoka.b4@tohoku.ac.jp  | 申込<br>2.14   |
| 21                 | 第7回 初心者にもわかる信頼性工学入門セミ<br>ナー(Web開催)   | 日本材料学会   | TEL 075–761–5321 jimu@office.jsms.jp<br>http://sinrai.jsms.jp/   |              |
| 24                 | LMP シンポジウム2022 レーザ加工技術の応用<br>と最新動向(Web 開催)   | 日本溶接協会   | TEL 03-5823-6324<br>http://www-it.jwes.or.jp/seminar/  | 定員<br>120名   |
| 25                 | トライボシンポジウム第 <b>24</b> 回「トライボコーテ<br>ィングの現状と将来」(和光)  | 理化学研究所大森<br>素形材工学研究<br>室,トライボコー<br>ティング技術研究<br>会     | TEL 03–5918–7613<br>tribo@tribocoati.st<br>http://www.tribocoati.st  | 定員<br>65名    |
| 25                 | 第34回軽金属セミナー「アルミニウム合金の組<br>織一応用編(加工・熱処理による組織変化)」<br>(Web開催)                                     | 軽金属学会  | http://www.jilm.or.jp/   | 定員<br>40名    |
| 2022年3月            |  |  |  |              |
| 3                  | ウィンタースクール「トポロジー最適化の基礎~<br>積層造形によるものづくりへの応用~」(Web 開<br>催)                                       | 日本計算工学会  | TEL 03-3868-8957<br>office@jsces.org https://www.jsces.org/  | 2.18         |
| 7                  | 第47回「組織検査用試料の作り方(組織の現出)」<br>講習会鉄鋼材料・非鉄金属材料・表面改質処理<br>および異常組織材(Web 開催)                          | 材料技術教育研究<br>会  | TEL 047–431–7451<br>jimukyoku@mskoshukai.jp<br>http://www.mskoshukai.jp  | 定員<br>100名   |
| $7\sim 9$          | 第13回日本複合材料会議(JCCM-13)(大阪 + Web 開催)   | 日本材料学会,日<br>本複合材料学会                                  | TEL 075–761–5321 jimu@jsms.jp<br>http://www.jsms.jp  |              |
| $7\sim 9$          | 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ(Web 開催)   | 高エネルギー加速<br>器研究機構物質構<br>造科学研究所, J-<br>PARC センター<br>他 | qbsf2021-office@ml.j-parc.jp<br>https://mlfinfo.jp/sp/qbs-festa/2021/  |              |
| 10~11              | 表面科学セミナー2022(実践編)「実践! マテリ<br>アルズインフォマティクス 実例を通じて学ぶマ<br>テリアルズインフォマティクス」(Web 開催)                 | 日本表面真空学会   | TEL 03-3812-0266<br>office@jvss.jp<br>https://www.jvss.jp/   |              |
| 11                 | 第100回レアメタル研究会(東大生産技研+Web<br>開催)(本号124頁)  | レアメタル研究会   | TEL 03–5452–6314<br>okabelab@iis.u-tokyo.ac.jp<br>https://www.okabe.iis.u-tokyo.ac.jp/<br>japanese/rc40_j.html   |              |
| 15~17              | 日本金属学会春期講演大会(オンライン開催)(本<br>号115頁)  | 日本金属学会   | TEL 022-223-3685 FAX 022-223-6312<br>annualm@jim.or.jp   | 参加予約<br>2.25 |
| 22                 | 日本金属学会春期講演大会ポスターセッション<br>第7回「高校生・高専学生ポスターセッション」<br>(Web 開催)(1 号53頁)                            | 日本金属学会   | TEL 022–223–3685 annualm@jim.or.jp   |              |
| 29                 | キンク研究会 2022年度研究会<br>「ミルフィーユ構造物質のキンク強化:実験と理<br>論の両面からのアプローチ」(Web 開催)                            | 研究会 No. 75<br>キンク研究会                                 | fujii.t.af@m.titech.ac.jp  | 3.22         |
| 2022年 5 月<br>11~12 | 第38回希土類討論会(熊本)   | 日本希土類学会  | TEL 06-6879-7352<br>kidorui@chem.eng.osaka-u.ac.jp<br>http://www.kidorui.org/                                    | 発表<br>1.21   |
| 11~13              | 日本顕微鏡学会第78回学術講演会(郡山+Web開催)   | 日本顕微鏡学会  | TEL 03–6457–5156<br>jsm-post@microscopy.or.jp<br>http://conference.wdc-jp.com/microscopy/<br>conf2022/index.html |              |
| $27 \sim 29$       | 第142回春期大会(大阪大学)  | 軽金属学会  | https://www.jilm.or.jp/  |              |
| 2022年6月            | 9099年 年 御 从 加 丁 左 夭 洪 定 人 (171 1 181/四)  | 口卡甜炸茄。   |  |              |
| 3~5<br>2022年7月     | 2022年皮塑性加工   | 日本堅性加上字会   | nup://www.jstp.or.jp   |              |
| $6 \sim 8$         | 第59回アイソトープ・放射線研究発表会(東京)  | 日本アイソトープ<br>協会                                       | TEL 03–5395–8081<br>gakujutsu@jrias.or.jp<br>http://www.jrias.or.jp/   |              |

| 開催日        | 名称・開催地・掲載号  | 主催                                    | 問合先   | 締切 |
|------------|---|---------------------------------------|---|----|
| 2022年8月    |   |                                       |   |    |
| $3 \sim 6$ | ICYRAM2022(福岡)  | MRS–Japan                             | TEL 092–802–2755<br>mtanaka@chem-eng.kyushu-u.ac.jp<br>https://icyram2022.wixsite.com/official-site |    |
| 2022年9月    |   |                                       |   |    |
| $4\sim 8$  | 第18回アルミニウム合金国際会議(ICAA18)(富<br>山)  | 軽金属学会                                 | http://www.icaa18.org/  |    |
| $4 \sim 9$ | 第18回液体及びアモルファス金属国際会議<br>(LAM18)(広島)   | 第18回液体及び<br>アモルファス金属<br>国際会議組織委員<br>会 | TEL 082-424-6555<br>masinui@hiroshima-u.ac.jp<br>https://lam-18.hiroshima-u.ac.jp/                  |    |
| 21~23      | 日本金属学会秋期講演大会(福岡工業大学)(予定)  | 日本金属学会                                | TEL 022-223-3685 FAX 022-223-6312<br>annualm@jim.or.jp  |    |
| 2022年11月   |   |                                       |   |    |
| 22~25      | The 1st International Symposium on Iron Ore Ag-<br>glomerates (SynOre2022)(第1回鉄鉱石塊成鉱<br>に関する国際シンポジウム)(島根) | SynOre2022 組 織<br>委員会,日本鉄鋼<br>協会      | TEL 03-6369-9984<br>synore2022@issjp.com<br>https://synore2022.com/index.html                       |    |

~2022年度の会費お払込について~
2022年度の会費お払込のお手続きはお済みでしょうか、会員の皆様には,既にお手続きのご案内をお送りいたしておりますが,お手続きが未だの方は,ご対応をお願いいたします。
尚,本会ホームページの会員専用ページからは支払いの確認や,クレジットカード決済などができます。
また,ご連絡先住所の変更もこのページからできますのでご利用下さい。
JMホームページ
入会・会員 → 〔会員マイページ〕 → ID & パスワード入力 → 会費決済 or 各種変更届手続きへ

 $\diamond$   $\diamond$   $\diamond$ 

|   |  |   | (五十音順, 敬称略)   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|---|--|
| 委 員 長<br>副 委 員<br>委                       | 竹田<br>修明<br>一<br>形<br>市<br>市<br>志<br>直<br>直<br>査<br>に<br>古<br>間<br>小<br>森<br>田<br>寺<br>長<br>本<br>宮<br>山<br>中<br>志<br>島<br>原<br>辺<br>本<br>岡<br>山<br>町<br>市<br>島<br>原<br>辺<br>本<br>岡<br>山<br>町<br>寺<br>長<br>寺<br>長<br>子<br>寺<br>奏<br>雄<br>美<br>貴<br>子<br>高<br>ら<br>彰<br>末<br>本<br>四<br>小<br>篠<br>田<br>寺<br>長<br>本<br>岡<br>小<br>篠<br>田<br>寺<br>長<br>本<br>岡<br>小<br>篠<br>田<br>寺<br>長<br>本<br>岡<br>一<br>市<br>祐<br>透<br>昌<br>い<br>茶<br>本<br>四<br>山<br>田<br>島<br>原<br>辺<br>本<br>岡<br>一<br>市<br>祐<br>透<br>昌<br>い<br>茶<br>本<br>四<br>一<br>本<br>岡<br>小<br>篠<br>田<br>寺<br>長<br>本<br>岡<br>間<br>崎<br>本<br>二<br>二<br>本<br>岡<br>小<br>篠<br>田<br>寺<br>長<br>本<br>岡<br>町<br>志<br>志<br>高<br>ら<br>訪<br>元<br>志<br>二<br>本<br>二<br>町<br>志<br>志<br>吉<br>古<br>祐<br>洗<br>西<br>一<br>二<br>本<br>二<br>一<br>本<br>二<br>二<br>本<br>二<br>一<br>二<br>本<br>二<br>二<br>本<br>二<br>二<br>二<br>本<br>二<br>二<br>二<br>二<br>本<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>一<br>二<br>二<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>二<br>一<br>二<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>二<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>二<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>二<br>一<br>二<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>二<br>一<br>一<br>一<br>一<br>二<br>一<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>一<br>二<br>二<br>二<br>一<br>二<br>二<br>二<br>一<br>二<br>二<br>二<br>一<br>二<br>二<br>一<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>一<br>一<br>一<br>一<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二 | 井川小佐高圓豊春眞山田西柳々島谷不本山崎太咲禎秀克貴太高 由勝以子彦顕利夫郎志剛勝 | 植木小佐高寺永藤三山木口山藤山西井井井中洗賢元豊直 好謙井中神龍道人樹亮崇進古太子 好謙                | 字七쬵芋是馽乏公诸吉部村藤泽 一雄 祐直 洋 規司浩太愛介人誠明聡治              | 大國近鈴趙土永松宮山<br>塚枝藤木 井瀬浦さ知<br>山本<br>東大紀<br>研郎嗣志か<br>一 |  |
| まてりあ第61巻<br>発行所 公益社団》<br>〒980-8<br>TEL 02 | 第2号(2022) 発行日 20:<br>ま人日本金属学会<br>3544 仙台市青葉区一番町一丁目<br>22-223-3685 FAX 022-223-€  | 22年2月1日 5<br>発行<br>14-32 印刷<br>5312 発売    | 2価1,870円(本体1<br>人 山村英明<br>所 小宮山印刷ユ<br>所 丸善雄松堂株<br>〒160-0002 | <b>,700円+税10</b> 5<br>二業株式会社<br>株式会社<br>東京都新宿区国 | %)送料120円<br>四谷坂町 10-10                              |  |



仕様

作業ホイール寸法 Ø 300~350mm サンプルホルダー(数) Ø159 - 204 mm 研磨剤自動供給(オプション) 4-ダイヤモンド懸濁液、1-潤滑剤、1-酸化物研磨剤 作業ホイール数 1面 電源 三相 220-240V / 50/60Hz 接続ロード:6kVA 回転速度 作業ホイール: 50~600rpm ポリッシングヘッド: 50~350rpm 回転方向 反時計方向(ポリッシングヘッドのみ時計方向可) 寸法 (W)x(D)x(H) 901x710x265mm 中央荷重:20~400N 荷重 重量  $\sim$  420kg

### ヴァーダー・サイエンティフィック株式会社



東京本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-8-8 TEL:03-5367-2651 FAX:03-5367-2652 info@verder-scientific.co.jp 
 Scientific
 名古屋営業所へのQATM製品に関するお問い合わせは:

 TEL:06-6655-0003 Fax:06-6629-8080
 900-9002-5421 (名古屋営業所 所長 赤星)

名古屋営業所:〒460-0003愛知県名古屋市中区錦2-9-14伏見スクエアビル5F TEL:03-5367-2651(東京本社)Fax:03-5367-2652(東京本社)



# 領域を超えると、可能性は無限大。

乗り物の軽量化。工場の省エネ化。水素ビジネスの推進。電力の安定供給。 人々の暮らしを支え、社会の課題に挑んできた私たちの独創的な「技術力」は、 幅広い事業分野それぞれが持つ、知見を掛け合わせることで磨かれてきました。 これからも、複合経営ならではの領域を超えた開発力を活かし、 「技術」の無限の可能性に挑んでいきます。

「素材」「機械」「電力」で、未来を切りひらく。

